生体埋植型 CMOS イメージングデバイスの 信号対雑音比向上とフレキシブル化に関する研究

一 博士学位論文 一

山口 貴大

2018年3月

奈良先端科学技術大学院大学

物質創成科学研究科

目次

第1章序論	1 -
1.1 本研究の背景	1 -
1.2 埋植型イメージングデバイスの位置付け	3 -
1.3 埋植型イメージングデバイス	4 -
1.3.1 CMOS イメージセンサ	5 -
1.3.2 イメージングシステムとポストプロセッシング	6 -
1.3.3 脳表面計測用イメージングデバイス	7 -
1.3.4 脳深部計測用イメージングデバイス	8 -
1.3.5 吸光度観察用イメージングデバイス	9 -
1.3.6 蛍光観察用イメージングデバイス	9 -
1.4 本研究の目的	10 -
1.5 本論文の構成	
第2章 自己リセット型 CMOS イメージセンサによる明環境下蛍光イメージング	12 -
2.1 はじめに	12 -
2.2 自己リセット方式を用いたイメージセンサ画素	14 -
2.2.1 自己リセット画素の回路構造と動作	14 -
2.2.2 自己リセット画素の信号対雑音比	19 -
2.2.3 自己リセット画素のレイアウト設計	23 -
2.3 埋植用自己リセット型 CMOS イメージセンサ	24 -
2.3.1 埋植用自己リセット型イメージセンサのチップレベル設計	24 -
2.3.2 埋植用自己リセット型イメージセンサの特性評価	25 -
2.4 明環境下蛍光イメージング	29 -
2.4.1 明環境におけるマウス脳神経細胞蛍光イメージング実験系	29 -
2.4.2 自己リセット型イメージセンサによる撮像結果	30 -
2.5 考察とまとめ	
第3章低消費電力型自己リセットセンサによる高信号対雑音比脳機能イメージン	グ33 -
3.1 はじめに	33 -
3.2 神経活動に伴う内因性信号の発現機構	34 -
3.3 低消費電力型自己リセットセンサの開発	37 -
3.3.1 第2章で開発した自己リセット画素のノイズ解析	37 -
3.3.2 自己リセット画素回路の低消費電力化	39 -
3.3.3 低消費電力型自己リセットイメージセンサのチップ設計	- 41 -
3.3.4 低消費電力型自己リセットセンサの特性評価	43 -
3.3.5 出力特性の従来画素および理論式との比較	44 -
3.4 低消費電力型自己リセットセンサ搭載の埋植デバイス	47 -
3.5 内因性信号イメージング実験	49 -
3.5.1 実験動物の準備とイメージングデバイスの埋植	49 -

3.5.2 脳表面の撮像と自己リセットセンサ出力の復元	51 -
3.5.3 体性感覚刺激に応じた神経活動の測定	55 -
3.6 考察とまとめ	61 -
第4章 埋植用フレキシブルデバイスプラットフォームの開発	62 -
4.1 はじめに	62 -
4.2 フレキシブルデバイスによる広範囲脳機能イメージング	63 -
4.3 フレキシブルエレクトロニクスの応用	64 -
4.4 デバイスプロセス	65 -
4.4.1 デバイスの構成材料	65 -
4.4.2 プロセスチャート	66 -
4.4.3 プロセスの構築について	70 -
4.5 フレキシブルイメージングデバイスの試作と埋植実験	73 -
4.5.1 フレキシブルイメージングデバイス	73 -
4.5.2 実験動物の準備とフレキシブルイメージングデバイスの埋植	75 -
4.5.3 脳表面血流動態の観察	77 -
4.5.4 フレキシブルイメージングデバイスの埋植実験:考察とまとめ	83 -
4.6 デバイスの発展性について	84 -
4.7 まとめ	87 -
第5章結論	88 -
5.1 本研究の成果	- 88 -
5.2 今後の展望	89 -
付録	91 -
自己リセット画素回路の遷移過程と低消費電力化の方策	91 -
発表目録	93 -
謝辞	101 -
参考文献	- 103 -

第1章 序論

1.1 本研究の背景

脳の働きを理解することは大いなる挑戦であり,17~18世紀にかけて実験的に脳の 実体を明らかにする試みが始まって以来,絶え間なく科学的知見が積み重ねられてき た[1].特に近年では,細胞染色法の発達による細胞の分類や微小電極の開発による膜 電位の観察,電子顕微鏡の開発によるニューロン構造の解明,Computed tomography (CT)やMagnetic resonance imaging (MRI)といった非侵襲的断層撮像法の開発による生 体脳の画像化など,革新的な手法の開発によって急速に知見が拡大している[1].

脳機能の解明においては、特に生体脳の観察が重要である.神経回路の物理的なネ ットワーク自体は、脳を極薄くスライスし、各切片を2光子顕微鏡で観察した後、コ ンピューティングによって再構築することで脳全体に渡る3次元構造を詳細に分析 することができる[2].しかし、脳機能の解明においては、物理的な構造の観察のみか らその機能を十分に推察することは困難であり、生体脳において、特に生体の行動に 関連した情報伝達構造を大量の実験データから統計的に明らかにしていくことが重 要であると指摘されている[3].そのため、多数の神経細胞が成す神経回路の物理的な ネットワーク構造と情報伝達構造をリアルタイムで可視化できる、広視野・高時間・ 高空間分解能な計測装置を、生体が自由行動できるほど小型・軽量な形態で埋植する 技術を開発することができれば、神経科学の発展において大きな飛躍をもたらすこと ができると期待される.

一方で、"現代の神経科学は元素表が提案される以前の化学のようだ. すなわち、元 素や化合物についての知見はあるが、知見を分類する体系的な理論が欠落している." [4]と評されるように、神経活動の機能面に関する体系的な理論は異なるスケールの事 象が複雑に関連するため未だ解明されておらず[5]、個別の神経細胞から複雑な神経ネ ットワーク、ひいては脳全体までのダイナミクスをシームレスに観察する手法の開発 が急務となっている[6]-[8].

個別の神経活動を観察する方法としては微小電極を用いる手法が伝統的であり, 1950年代から徐々に同時観察可能な細胞数を増やしているものの,原理的に複数の 神経細胞に由来する信号を識別して切り分けることが困難であるなど,神経回路を解 明するために必要となる数千もの細胞数を同時に測定するには未だ根本的な課題が 残る[1],[8].電子顕微鏡による観察も生体への適用は難しい.また,CTやMRI,Positron emission Tomography (PET),Optical tomography (OT)といった非侵襲的断層撮像法[9]– [12]も,原理的に空間分解能が数mm程度にとどまるため,sub-mmスケールの神経回 路構造の解明に用いるのは難しい[2]. それに対し,新たな神経活動の観察方法として光学的画像計測法が提案されている [1]. これは,電位感受性色素などの蛍光標識を脳内に導入したり[13]-[15],生体が本 来的に持つ内因性信号を利用したりして[16],[17],神経活動を光強度の変化として光 学的に可視化する手法であり,脳への侵襲性を減らしながら高い分解能で多数の神経 細胞の活動を同時に観察できるため,幅広いスケールでの観察が可能になると期待さ れる.これまでに自由行動下での光学的画像計測法による脳機能イメージングを実現 する手法として,光ファイバ[18]-[21]や小型顕微鏡[22]-[24]を脳に埋植し光学的計測 を行う手法が提案されているが,それぞれファイバの硬さや光学系の重さが小動物の 行動を制限し,実用性が十分とは言えなかった[25].

奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 光機能素子科学研究室では、上記技術を実現するため、小型 Complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)イメージセンサを搭載した超軽量埋植型イメージングデバイスの開発を継続的に行っている[26]-[29]. 埋植型 CMOS イメージングデバイスは、実験小動物の脳内に直接 CMOS イメージセンサを埋め込み、レンズレスでイメージングを行う.これにより、デバイスを小動物の自由行動に十分な超軽量・超小型形状としつつ、時間・空間分解能が十分高く広視野での観察が可能な脳機能計測装置を実現することができ、脳神経科学の飛躍的な発展に貢献すると期待される.本研究は上記埋植デバイスの実用化に向け、センサのダイナミックレンジおよび信号対雑音比向上による応用範囲の拡大と、フレキシブルな有機薄膜上への半導体素子実装技術の開発によるデバイス侵襲性の低減について、基礎的な検討を加えることを目的とする.

1.2 埋植型イメージングデバイスの位置付け

生体の脳神経活動を測定する手法としては、電気生理学的な手法[30]-[32]や核磁気 共鳴による手法、光音響による手法、光学的手法などが提案されている.

電気生理学的手法では脳組織中に直接微小電極を埋植することで神経細胞の膜電 位を測定し、神経活動を電位変化として直接観察する. 伝統的な手法であり、個別の 神経細胞または局所的な神経細胞群の神経活動を高い時間分解能で測定することが できるものの、神経回路を解明するために必要となる数千もの細胞数を測定するには それに匹敵する電極を脳内に埋植せねばならず、生体侵襲性の面で根本的な課題が残 る.

機能的核磁気共鳴(Functional magnetic resonance imaging, fMRI)を用いた手法[33], [34]は脳血流量の変化を核磁気共鳴信号の強度変化として測定するもので,非侵襲で 生体脳の脳機能を可視化できることが最大の特徴であるが,装置の小型化が困難であ り,分解能が低く(~数 mm)神経回路レベルの神経活動観察には不向きである.

光音響による手法[35], [36]はナノ秒レベルのレーザ光パルスを生体組織に照射し, 生じる音響波を測定することによって組織構造や血液量,酸素飽和度をイメージング する手法である.照射光波長の数分の一に迫る高空間分解能のイメージングが可能と なる一方で,光学系が複雑となり,自由行動下計測への応用には課題がある.

光学的な手法としては,電位感受性色素(Voltage sensitive dye, VSD)[18], [37], [38], カルシウムイオン濃度に感受性を持つ蛍光色素[39], [40],内因性の蛍光物質(フラビ ン蛋白)[41], [42]などを用いた蛍光イメージング法や,代謝に伴う血流変化や酸素飽 和度の変化といった内因性信号を可視光[43]や近赤外光[44]の吸光度変化として測定 する手法が挙げられる.光学的手法は測定部が必ずしも神経細胞に隣接する必要がな いため,測定装置を集約して侵襲性を低減しながら,多数の神経細胞を同時測定する ことができる.VSDは信号が微弱であるが応答が速いことから,神経活動を高い時間 分解能(~ミリ秒)で測定することができる.またカルシウムイメージングは応答が 遅い(~数秒)ものの細胞ごとに信号変化が特異的であり,個別の神経細胞を分別で きる高空間分解能な観察が可能である.フラビン蛋白は応答が遅い(~数秒)ものの, 生体に自然に存在する物質で,蛍光標識導入のデメリット(煩雑な実験手順や毒性) がなく,信号変化が比較的大きい(~数十%).内因性信号の吸光度観察も応答が遅い (~数秒)ものの,信号が内因性であるメリットに加え,蛍光観察では複雑になる光 学系が簡素で済むという長所を持つ.

埋植型イメージングデバイスは上記の光学的な手法をターゲットとしており,自由 行動下で多数の神経細胞により構成される神経回路を測定できる程度の高空間分解 能(~数+μm)かつ高時間分解能(~数+ミリ秒),広視野(>1[mm²])な低侵襲測 定法を目指している.同様のコンセプトを持ったデバイスとしては光ファイバ[18]-[21]や小型顕微鏡[22]-[24]を脳に埋植し光学的計測を行う手法が提案されており,高 い時間空間分解能かつ高信号対雑音比での測定を実現しているが、それぞれファイバの硬さや光学系の重さが小動物の行動を制限し、実用性が十分とは言えない[25]. 埋植型イメージングデバイスはレンズなどの光学系を持たない超小型・軽量の構成とし、実用に十分な性能で行動制限を最低限に抑えることを目標としている.

1.3 埋植型イメージングデバイス

埋植型イメージングデバイスは、マウスやラットといった小動物の自由行動下にお ける脳神経活動計測の実現を目指している[29].マウスやラットは取り扱いや飼育が 容易であること、繁殖の期間が短いこと、様々な病気や疾患のモデル動物が既に多く 存在することから、脳神経科学の分野では一般的に実験に用いられている.図1-1に 示すように、埋植デバイスを超小型・軽量とすることで、実験動物に過剰な負荷を与 えることなく脳機能イメージングが可能となり、よりストレスの少ない自然な状態に 近い実験結果が得られると期待される.例えば、図1-1に示す埋植デバイスは単体 の重量がわずか0.02[g]と生体マウスのおよそ1/1000~1/1500の重量となっており、 極めて軽量なデバイスを実現することができている.



図 1-1 埋植型イメージングデバイスによる自由行動下の脳機能イメージング [須永圭紀, Ph. D. thesis, 奈良先端科学技術大学院大学, 2017]

開発されているデバイスは、測定対象とする信号の違いや測定領域の違いからいく つかの種類に分類することができる.以下、埋植デバイスで用いる CMOS イメージセ ンサとイメージングシステムについて述べた後、これまでに開発された埋植デバイス を脳表面計測用、脳深部計測用、吸光度観察用、蛍光観察用に分類して概観する.

1.3.1 CMOS イメージセンサ

埋植型イメージングデバイスでは、撮像素子として CMOS イメージセンサを用い ている. CMOS イメージセンサは一般的な Large-scale integration (LSI)素子の製作プロ セスを用いて製作可能な素子であり、他の Charge-coupled device (CCD)といった撮像 素子に比べ安価で、より低電圧での駆動が可能であるとの特徴を持つ. 埋植デバイス では万一の際の漏電時に生体へ与えるダメージや、電子回路と生体を分離する構造の 複雑さなどを考慮すると、より低電圧で駆動できる方が好ましい. また、CMOS セン サは素子内に信号処理を行うデジタル回路やアナログ回路を組み込むことができ、回 路的な工夫による特性の向上が可能である点も大きな特徴である[45].

埋植型イメージングデバイスで用いられている標準的な CMOS イメージセンサの レイアウト図とブロックダイアグラムを図 1-2 に示す.埋植用イメージングデバイ スは侵襲性を抑制するため、チップ面積を最小限に抑える必要がある.また、チップ と外部基板の配線数もデバイスのサイズや重量に大きく関わるため、これも最小限に 抑える必要がある.そのため、市販されている CMOS イメージセンサでは一般的なオ ンチップの Analog-to-digital (A/D)コンバータなどは搭載しておらず、A/D 変換はオフ チップで行う仕様となっている.また配線数も電源(VDD,GND)とクロック(xclk)、出 力(OUTPUT)の4極で駆動可能となっている.本研究ではイメージセンサの基本的な 構成は図 1-2のセンサに準じ、必要に応じて改良を加えている.



図 1-2 埋植用 CMOS イメージセンサ(左) レイアウト(右) ブロックダイアグラム [須永圭紀, Ph. D. thesis, 奈良先端科学技術大学院大学, 2017]

1.3.2 イメージングシステムとポストプロセッシング

図1-3に埋植用 CMOS イメージングデバイスによる脳機能計測システムのブロッ クダイアグラムを示す. イメージングデバイスの他,小動物の胴体に搭載される小型 の信号中継器"中継基板"や,実験動物からは比較的離れた場所に設置され A/D 変換や 電圧レギュレータなどを搭載する"制御基板",そしてパーソナルコンピュータ(PC)を 用いてシステムを構成している. イメージングデバイスはこれらの基板を通して PC によって制御され,撮像された画像は独自開発の制御プログラム(C++)によって記録, 可視化される. また,制御プログラムは画像間の差分をリアルタイムに表示すること なども可能であり,簡便な血流の可視化など円滑に動物実験を進められる構成として いる.



図 1-3 CMOS イメージングデバイスによる脳機能計測システム [春田牧人, Ph. D. thesis, 奈良先端科学技術大学院大学, 2014]

1.3.3 脳表面計測用イメージングデバイス

大脳皮質は脳の高次機能が集中した領域であり,脳表面を光学的に計測することで, 視覚野,感覚野,運動野,聴覚野など多様な脳領域を比較的容易に観察することがで きる.これは外部刺激に対する脳神経活動を測定する上でも有利であり,これらの領 域を中心として多くの脳機能が解明されてきた.

埋植型イメージングデバイスにおいても観察が比較的容易な脳表面は重要なター ゲットの一つであり,脳表面計測に特化したデバイスが開発されてきた[28],[46].図 1-4 にこれまでに開発された脳表計測用イメージングデバイスを示す.これらのデ バイスは1.0×2.7×0.15 [mm³]の CMOS イメージセンサを用いており,チップ面積の 過半(0.9×2.0 [mm²])を画素が占めている.チップは Flexible printed circuit board (FPC) 上に実装され,6~9 個の Light emitting diode (LED)を搭載し,広い撮像領域を十分な 光強度で照射可能となっている.脳表計測用埋植デバイスは脳表面の観察のためセン サの画素領域を直接組織に接触させ、レンズレスでイメージングを行っている(コン タクトイメージング).これにより,競合する埋植デバイスに比べ遥かに軽量な構造 を実現している.





図 1-4 脳表計測用イメージングデバイス (左)[春田牧人, Ph. D. thesis, 奈良先端科学技術大学院大学, 2014] (右)[T. Kobayashi et al., Biosens. Bioelectron., vol. 38, no. 1, pp. 321–30, 2012]

1.3.4 脳深部計測用イメージングデバイス

一方で、脳の記憶や学習といったメカニズムの解明には、長期記憶を司る大脳皮質の他にも、短期記憶を司る海馬、感情を司る扁桃体など、脳深部の観察が重要となる. そこで、図1-5に示すような針状の埋植デバイスが提案されている[29]. 脳表計測用のデバイスとは異なり、脳深部計測はデバイスを脳に直接刺入する必要があることから、本デバイスはチップサイズが0.5×3.0×0.15 [mm³]と小型であり、撮像領域は0.3×0.9 [mm²]となっている.また、可能な限り侵襲する断面積を小さくするため、照明用のLED はチップ状に直接実装され、厚みも低減する工夫がなされている.本デバイスもコンタクトイメージングにより撮像する.



図 1-5 脳深部計測用埋植型イメージングデバイス [須永圭紀, Ph. D. thesis, 奈良先端科学技術大学院大学, 2017]

1.3.5 吸光度観察用イメージングデバイス

脳神経活動を光学的に観察する手法の一つとして、脳内の血流やヘモグロビン動態 を観察する手法が上げられる.詳しくは3章2節で後述するが、神経の興奮が生じる と、神経細胞などで酸素の代謝を伴うエネルギー消費が起こり、一時的に酸素要求度 が上昇する.これを補うため、神経細胞周囲の血管が自律的に伸縮し、血流量や血中 ヘモグロビンの酸素飽和度が過渡的な応答を示す.血流量の変化やヘモグロビンの酸 素飽和度の変化は特定波長の吸光度の変化として測定できるため、特定波長の照明と イメージセンサを用いて連続的な測定を行えば、間接的に神経活動を検出することが できる.血中物質の影を追跡して血流速を測定することによっても同様の観察が可能 である.デバイスとしては照明用の単色のLEDとカラーフィルタなどを搭載しない イメージセンサさえあれば測定できるので、デバイス構成が簡素で済み、試行回数の 多い実験に有利である.ただし、血流やヘモグロビン動態の変化は神経活動の数ミリ 秒の変化に対して~10秒程度のスケールと、応答性が悪い.吸光度の変化も数 mm の 範囲に渡って生じるので、神経活動が生じた神経細胞を特定するなども極めて困難で ある.デバイスの外観としては、例えば図 1-4(左)のデバイスが該当する.

1.3.6 蛍光観察用イメージングデバイス

脳神経活動計測のもう一つの代表的な手法として、蛍光による観察が挙げられる. これは、脳内に元来存在する蛍光物質や、あるいは先天的・後天的に脳内に導入した 蛍光標識を用いて脳神経活動を可視化する手法である.多様な蛍光標識が存在するが、 特定の神経細胞中に発現させたり、神経活動による電位変化に高速に応答したりなど、 吸光度計測に比べると空間分解能や時間分解能が高く、個別の神経細胞の特定や電位 スパイクのリアルタイム計測などが実現される特徴がある.イメージングデバイスに は蛍光の励起波長に合った光源や、励起光をカットしつつ蛍光のみの観察が可能な高 性能の光学フィルタが要求されるなど、吸光度観察に対してデバイス構成が複雑とな る.デバイスの例としては図 1-5 のデバイスが該当する. コンタクトイメージング による撮像では光の入射方向が多様であるため、干渉フィルタのような角度依存性が 高い光学フィルタは波長選択比が著しく悪化し不適当である. そのため、本デバイス には角度依存性が低い吸光型の光学フィルタが用いられている.

1.4 本研究の目的

埋植型イメージングデバイスは脳機能イメージングを目的としているが、脳機能イ メージングに用いられる蛍光標識や内因性信号の輝度変化率は 0.01-1%であり、その 測定には 40-80 [dB]の信号対雑音比が求められる.それに対し、従来の埋植用 CMOS イメージセンサのピーク信号対雑音比は一般的な CMOS イメージセンサと同等の 45 [dB]程度に留まっており、検出するためには一般的な顕微鏡を用いた観察実験と比較 してより強い刺激を行う必要があるか、場合によっては困難である.対応可能な蛍光 標識や内因性信号の範囲を拡大するためには、より一層の信号対雑音比の向上が望ま れる.蛍光標識を観察する際にはしばしば背景光や環境光などの意図しない漏れ光が 検出されるため、ダイナミックレンジ拡大によるロバスト性の向上も重要となる.ま た、生体に対し比較的硬い構造のデバイスが生体組織を傷つけ、出血や抗体反応によ る結合組織の形成を招き、長期の継続した観察を困難にしている.埋植デバイスの実 用化に向けては、生体の損傷を避ける構造の採用が課題となる.

そこで、本研究は生体埋植型 CMOS イメージングデバイスの実用化に向け、CMOS イメージセンサのダイナミックレンジおよび信号対雑音比向上による応用範囲の拡大と、フレキシブルな有機薄膜上への半導体素子実装技術の開発によるデバイス侵襲 性の低減について、基礎的な検討を加えることを目的とする.

1.5 本論文の構成

▶ 第2章

蛍光イメージングによる脳機能測定は特定の神経細胞群を対象とした分解能の高 い測定を実現するが、微弱な蛍光に対して白色のスペクトルを持つ環境光は大敵であ り、その観察は暗室中に限られている.一方で、生理学の分野では、生物の明環境下 と暗環境下における生理活動の差異、特に概日性リズムに関わる脳神経活動の変化に 多大な関心が払われており、明環境中における蛍光観察を実現することができれば、 脳をはじめとする生理活動の解明に大きな飛躍をもたらすと期待される.そこで、第 2章では、センサの実効的なダイナミックレンジを拡張できる自己リセット方式に着 目し、明環境下でも蛍光観察が可能な自己リセット型 CMOS イメージセンサの開発 を目指した.

▶ 第3章

内因性信号は、蛍光標識による測定手法に比べ時間応答や空間分解能では不利であ るものの、生体の標識など複雑な実験準備を行う必要がないため、脳機能の有力な計 測法の一つである.しかし、血中酸素飽和度の変化に伴う内因性信号は微弱であり、 その光学的な観察には高い信号対雑音比が求められる.一般的な CMOS イメージセ ンサと同じ構造のセンサを用いる従来の埋植型イメージングデバイスでは信号対雑 音比が十分とは言えず、内因性信号の検出には複数回の試行の平均をとるなどしてノ イズを低減しなければその検出は困難だった.そこで、第3章では自己リセット型 CMOS イメージセンサを用いて内因性信号検出における信号対雑音比の向上を目指 した.

▶ 第4章

埋植型イメージングデバイスの課題として,従来から撮像視野の拡大が挙げられて いる. 複数の脳領域を同時に観察することが可能となれば,他の脳機能イメージング 手法には困難な神経細胞レベルの脳内ダイナミクスの解明につながり,脳機能解明が 飛躍的に進むと期待されるが,従来のほとんどの埋植型イメージングデバイスでは撮 像視野が単一の脳領域程度に限られていた.これまでにも視野の拡大が試みられたが, デバイスサイズがマウスなど小動物に対して大きく,埋植下での自由行動が困難であ り,侵襲性も比較的大きくなってしまっていた.そこで,第4章ではデバイス構造を 根本的に見直し,生体侵襲性を抑えつつ視野の拡張が容易な埋植用フレキシブルデバ イスプラットフォームを提案した.

▶ 第5章

第5章では本研究の成果を総括し、課題や今後の展望について述べた.

第2章 自己リセット型 CMOS イメージセンサによる

明環境下蛍光イメージング

2.1 はじめに

蛍光によるイメージングは標的とする分子の特異性が高いため,脳機能計測の分野 で広く用いられている手法である[15],[25].遺伝的に導入した蛍光標識や,後天的に 投与した色素,あるいは組織自身の自家蛍光を用いて,脳領域の特定や,脳神経活動 の動態観察,神経伝達物質の可視化,免疫反応の可視化などを実現することができる.

蛍光イメージングにおける大きな課題の一つとして,環境光をほぼ完全に遮断した 暗環境下で観察を行わなければならないという点が挙げられる.通常,蛍光観察は蛍 光を励起する励起光と,励起光波長を遮断し蛍光波長のみを透過する光学フィルタ, および光学フィルタを通して光強度を測定する光学センサを組み合わせて行われる. このとき,蛍光波長を含むスペクトルを持つ環境光(室内の電灯や太陽光など)が入 射すると,容易に蛍光の数万倍以上の強度を持つ光が光学センサに到達し,蛍光と環 境光の比が一般的な光学センサのダイナミックレンジを上回るため,蛍光の観察が極 めて困難となる(図 2-1).一方で,生理学の分野では,生物の明環境下と暗環境下に おける生理活動の差異,特に概日性リズムに関わる脳神経活動の変化に多大な関心が 払われており[47]-[49],明環境中における蛍光観察を実現することができれば,脳を はじめとする生理活動の解明に大きな飛躍をもたらすと期待される.

そこで、本章では、センサのダイナミックレンジを拡張することができる自己リセット方式に着目し、明環境下でも蛍光観察が可能な自己リセット型 CMOS イメージ センサを開発した. 広ダイナミックレンジを実現する測定方式には他に対数出力方式 [50]や多重露光方式[51]、画素並列出力方式[52]などが挙げられるが、これらは A/D 変 換の分解能により、得られる信号の精度に本質的な制限が存在する[53]. 広ダイナミ ックレンジかつ高信号対雑音比を実現した横型オーバーフロー方式[54]も提案されて いるが、自己リセット方式の方がシステムとして簡便である. また、自己リセット方 式は幅広いレンジで一定の感度を保つことができるため、大きなバックグラウンド信 号に重畳する小さな信号の変化を検出する上で有利である.

開発した自己リセット型 CMOS イメージセンサを用い, 白色照明光を照射しなが ら緑色蛍光物質を発現したマウス脳スライスを観察し, 明環境中における蛍光観察が 可能であることを実証した. なお, 本章の内容は論文[55]および論文[56]の一部を基に 再構成したものである.





2.2 自己リセット方式を用いたイメージセンサ画素

2.2.1 自己リセット画素の回路構造と動作

自己リセットは露光過多による画素内容量の飽和を回避し,センサのダイナミック レンジを向上させる方式の一種である[57]-[61]. 本項ではまず CMOS イメージセン サで一般的な 3-Transitor 型画素について,画素回路と動作およびその限界について述 ベ,その後開発した自己リセット画素について同様に述べる.

ー般的な 3-Transistor 型画素の回路図およびタイミングチャートを図 2-2 および図 2-3 にそれぞれ示す. 一般的な 3-Transistor 型画素では, 画素に光が入射すると, 光 電変換素子 Photo Diode (PD)の寄生容量(画素内容量)に光強度に応じた電荷が蓄積 され, 画素内容量電圧 V_{PD} がリセット電 EV_{rst} から下降していく. 通常は, 一定期間ご とに M_{SEL} および後段の素子が開かれ, 数段のソースフォロワを経て画素内電 EV_{PD} が 読み出された後, 外部リセット信号 Φ_{EXRST} により M_{RST} が開いて V_{PD} が再度リセット電 EV_{rst} にリセットされ電荷の蓄積を再開する. 以上の動作により 1 Frame 分の露光が行われ, 図 2-7 に示すような入射光強度にほぼ比例する出力が得 られる. ところが, このとき入射光強度が高すぎると, 一定期間中に生じる電荷量が 画素内容量の容量を超え, それ以上の測定が困難となる. すなわち画素の飽和が生じ る.







Timing chart for the ordinal pixel

一方で、自己リセット画素は画素の飽和を回避し入射光強度の測定を継続するため に、画素内に画素容量の電圧V_{PD}の電圧低下を検出する機構を組み込み、飽和直前の 電圧に達したことを検出すると読み出しタイミングの前であっても画素容量を リセット電圧V_{rst}にリセットする.具体的な回路図を図2-4に、タイミングチャート を図2-5に示す.本章で開発した自己リセット画素は、一般的な3-Transistor 画素に V_{PD}を閾値と比較する Schmitt trigger インバータと自己リセットを行うリセット回路 を組み込み、10トランジスタで自己リセット機構を実現したものである.低照度下に おける信号対雑音比や感度を改善する画素構造として 4-Transistor 型画素が挙げられ るが、今回は高照度下での使用を前提としているため取り入れていない.

*V_{PD}*の電圧低下を検出する機構としてはインバータやコンパレータを用いる手法が 考えられ、コンパレータを用いて自己リセット機構を実現した報告もあるものの[58]-[60]、今回はトランジスタ数を低減し小型画素を実現するためにインバータを用いた. コンパレータを用いた構成では画素外部から自己リセットトリガ閾値*V_{TH_RST}*の参照 電圧を与えることができ、画素アレイ内で均一な自己リセットを実現できるという利 点がある.一方で、インバータを用いる構成では、インバータのトリガ閾値*V_{TH_RST}*が 半導体製造プロセスに依存するため、各画素間で一定のばらつきを持つ.しかし、こ のようなばらつきは各画素の固定パターン雑音として扱うことができるため、実用上 は画像処理により回避できる.また、フレーム間の相対的な輝度変化に着目するよう な用途では問題となりにくい.

インバータを用いる上では、図2-6(a)-(c)に示すように、いくつかの回路構成が考 えられる.例えば、最も基本的な(a) CMOS インバータは最低2つのトランジスタか ら構成できる.しかし、このような単純な CMOS インバータは雑音を含む入力電圧の 変化に対して出力が反転する遷移領域で不安定になりやすい.これは今回のようなフ ィードバックを含む回路において意図しないフリッカを引き起こしかねず、不適であ る.そこで、今回は入力にヒステリシス特性を持ち比較的少数のトランジスタで構成 可能な(b) Schmitt trigger インバータを用いた. ヒステリシス特性により入力のゆらぎ に対して出力が安定し,意図しないリセットやフリッカを抑制することができる. 実 際に用いた Schmitt trigger インバータは回路の半分を構成する n-sub-circuit を n 型ト ランジスタ1個に置き換えたもの(c)である. これは,ヒステリシスは入力が立ち下が る際のみにしか持たない. しかし,フリッカを抑制する目的ではヒステリシス特性は 片側だけで十分であり,また実際上立ち上がり入力はごく短時間に変化するため,立 ち上がりの入力に対するヒステリシスは必須でない. そこで,今回は安定性を確保し ながらトランジスタ数を低減するため, n-sub-circuit を省略した Schmitt trigger インバ ータを用いた. 図 2-6 (左) には各インバータの回路構成とゆらぎを含む入力に対す る出力のシミュレーション結果を示す.

リセット回路を構成する*M_{EXRST}およびM_{INRST}はそれぞれ外部リセットおよび自己* リセットを制御するトランジスタであり,目的はどちらもVppをVrstに初期化すること である. 従って, これらのソースードレイン極をV_{PD}-V_{rst}間に直結する構成も考え得 る.しかし、特にM_{INRST}のゲート電圧V_{SR}はV_{PD}が閾値V_{TH RST}を超えると、急激にLow 状態から High 状態に変化し、 V_{PD} をリセット電圧 V_{rst} に充電し始めるが、 V_{PD} が M_{n1} の 閾値電圧を超えると再び急激に High 状態から Low 状態に変化する. M_{n1}の閾値電圧 はリセット電圧Vrstより低いため、その結果、Vppがリセット電圧Vrstに達する前にリ セット動作が終了してしまい、外部リセットによるリセット条件よりもVppの出力振 幅が著しく制限されてしまう. そこで, 電流制限負荷M_bおよび共通リセットトランジ スタ M_{RST} を追加し、 M_{EXRST} を M_{INRST} と対照な位置に置いた.この構成では、タイミン グチャート図 2-5 に示すように、外部リセットまたは自己リセットトリガにより VDRST が Low 状態に瞬間的に変化した後、それらが基底状態に戻りMEXRST および M_{INRST}が閉じた状態となっても、電流制限負荷M_bおよびM_{RST}などの寄生容量によっ て RC 回路が形成され、VDRST が High 状態に戻るまで一定の遅れが生じる.実際には V_{DRST} が M_{RST} の閾値電圧 M_{THRST} を超えた時点でリセットが終了するが、これはバイア ス電圧Vbを適切に調節すれば自己リセットのハードリセットに十分な時間となる.ま た,外部リセットと自己リセットが同じM_{RST}で行われるため,トランジスタの製造ば らつきによる電圧のばらつきが抑えられる. さらに, *M_{RST}*は p型トランジスタで構成 できるため,通常 n 型トランジスタのみで構成される 3-Transisitor 画素よりもリセッ ト電圧V_{rst}を引き上げ、電圧スイング幅を大きくとることができる.

SPICE シミュレーションの結果, 電源電圧 V_{dd} = 3.3 [V], バイアス電圧 V_b = 2.4 [V], リセット電圧 V_{rst} = 2.8 [V]とした. このとき,自己リセットに必要な時間は 1 [µs]以下 であり,これは本センサに求められる露光時間(>1 [ms])より十分に短く,撮像結果に 大きく影響しない. また,自己リセット回路の各ピーク電流は,それぞれ I_{Mb} = 1.6 [µA], I_{s1} = 15 [µA], I_{s2} = 27 [µA], であった. ただし, n 型および p 型トランジ スタの閾値電圧は Austria Micro Systems (ams) 0.35-µm 2-poly 4-metal standard CMOS process に基づき,それぞれ 0.8 [V], 2.4 [V]とした.



A self-reset pixel circuit









(c) Schmitt trigger inverter without n-sub-circuit, 4 transistors

2.2.2 自己リセット画素の信号対雑音比

画素のランダムノイズに関して、一般的な 3-Transistor 画素の場合、比較的低い光強 度下では回路やトランジスタ構造に起因する雑音(kTC 雑音, 1/f 雑音, 熱雑音, Random telegraph signal (RTS)雑音)が支配的となる.これは照射光強度に関わらず一定である. 一方より高い光強度下では、光の量子性に起因する光ショット雑音が支配的となり、 光子密度(および光電変換によって生じたフォトキャリア)がポアソン分布に従うた め、ノイズ量はフォトキャリアの平方根に比例するようになる[45].つまり、一般的 な 3-Transistor 画素のノイズ量σ_{NORMAL}は以下のように表せる.

$$\sigma_{NORMAL} \simeq \sqrt{\sigma_{RST}^2 + \sigma_{SN}^2}$$

$$\sigma_{RST} \simeq const.$$

$$\sigma_{SN} = S\sqrt{n} \qquad \cdots 2-1$$

$$= \sqrt{S_{N}K}$$

$$\sqrt{S \cdot V_{sig}} \qquad \qquad \cdots 2-2$$

 $(:: V_{sig} = S \cdot n) \qquad \dots 2-3$

ただし、 σ_{RST} はリセット雑音、 σ_{SN} は光ショット雑音、Sはセンサのアンプ増幅率や A/D 変換等を含むゲイン、nはフォトキャリア数、 V_{sig} は出力信号値. 従って一般的な 3-Transistor 画素の信号値とノイズ量の関係を両対数グラフで模式的に示すと、図 2-7 のように表される.



Output characteristic of the ordinal 3-Transistor pixel

自己リセットセンサにおいても基本的には同様だが、自己リセットのたびに生じる 回路雑音がこれに加わる.理想的には外部リセットと自己リセットのノイズ量は同等 とみなせる.すなわち、N回の自己リセット後の自己リセット画素のノイズ量*σ*_{SELFRST} は以下のように表せる.

$$\sigma_{SELFRST} \simeq \sqrt{(N+1)\sigma_{RST}^2 + \sigma_{SN}^2} \cdots 2-4$$

このとき、測定レンジ全域において感度一定とし、本来の信号量を V_{sig} 、出力信号の振幅を V_{swing} 、出力信号を V_{sRout} とすると、理想的には以下の関係が成り立つ.

$$V_{sig} = N \cdot V_{SWING} + V_{SRout}$$
 ... 2-5

すなわち,

$$V_{SWING} = rac{V_{sig} - V_{SRout}}{N}$$

このとき,自己リセット画素の性質から

$$\frac{V_{sig}}{N+1} < \frac{V_{sig} - V_{SRout}}{N} \le \frac{V_{sig}}{N}$$

であるから,照射光強度が十分強く,自己リセット回数Nが十分多いとき,

$$V_{SWING} \simeq \frac{V_{sig}}{N+1}$$
 ... 2-6

とできる. よって, 式 (2-2), 式 (2-4), 式 (2-6) より,

$$\sigma_{SELFRST} \simeq \sigma_{SN} \sqrt{\frac{(N+1)\sigma_{RST}^2}{\sigma_{SN}^2} + 1}$$

$$\simeq \sigma_{SN} \sqrt{\frac{(N+1)\sigma_{RST}^2}{S \cdot V_{sig}} + 1}$$

$$= \sigma_{SN} \sqrt{\frac{\sigma_{RST}^2}{S \cdot V_{SWING}} + 1}$$

$$= \sigma_{SN} \sqrt{\frac{(\sigma_{RST}^2)^2}{V_{SWING}} + 1} \cdots 2.7$$

となる. このとき, $\frac{\sigma_{RST}}{s}$ はリセット雑音をキャリア数で表した値に相当し, $\frac{V_{SWING}}{s}$ は画 素容量中に蓄えられるキャリア数の最大量を表すため,式 (2-7) は $(\frac{\sigma_{RST}}{s})^2 \ll \frac{V_{SWING}}{s}$ のとき $\sigma_{SELFRST} \simeq \sigma_{SN}$, すなわち画素の Full well capacity (FWC)に対してリセット雑音 が十分小さい時,自己リセットにより加わるリセット雑音は無視し得る事を示している.自己リセット画素の信号量とノイズ量の関係を両対数グラフで模式的に示すと,図2-8のように表される.

実効的な信号対雑音比SNR_{eff}は式(2-5)より

$$SNR_{eff} = 20 \log \frac{V_{sig}}{\sigma_{SELFRST}}$$
 ... 2-8

と表せる.

次項で詳述するが、本章で開発した自己リセット画素は回路面積低減のため、画素 内や外部回路に自己リセット回数を計数するカウンタを持たない.しかし本章の実験 のように、自己リセット回数が変化しないほど微小な輝度変化を測定する用途では自 己リセット回数Nを測定または推定する必要はほとんどなく、自己リセットが生じた としても変化が高速かつ過大でなければNの変化を容易に推定することができる.ま た、自己リセットを起こさない程度の低照度で参照画像を撮像する、または低照度か ら徐々に強度を上げ信号値の時間的な不連続部分をリセット回数として数え上げる などして、後処理によって推定可能である.



図 2-8 自己リセット画素の出力特性 Output characteristic of the self-reset pixel

2.2.3 自己リセット画素のレイアウト設計

これまでに報告された自己リセット型の画素[58], [59], [61]では,画素内に自己リセット回数を計数するカウンタを備え、このリセット回数と出力信号から本来の信号量の推定を行っている.しかし、このようなカウンタは回路規模が増大しがちであり、 画素サイズが空間分解能に直結する埋植型のレンズレスイイメージングデバイスの 用途には不適となる.例えば、先行研究[58], [59], [61]では画素内のトランジスタ数が 20-30 程度となっており、画素サイズは 25×25 [µm²]から 49×49 [µm²]である.今回 はセンサの使用条件を微弱な輝度変化の検出に特化することで、カウンタを不要とし、 また回路構成を最適化することにより、トランジスタ数 10、15×15 [µm²]の画素を実 現した.これは脳神経細胞や毛細血管と同程度の大きさで、埋植型のレンズレス脳機 能イメージャに十分な画素の小ささである.受光部のフィルファクターは 31%である. 図 2-9 に設計した自己リセット画素のレイアウトを示す.フォトダイオード(PD)は n-well/p-subのダイオード構造で構成されており、光電子の蓄積には PD の寄生容量を 用いている.



図 2-9 自己リセット画素の回路レイアウト Circuit layout of the self-reset pixel

2.3 埋植用自己リセット型 CMOS イメージセンサ

2.3.1 埋植用自己リセット型イメージセンサのチップレベル設計

設計した自己リセット画素をアレイ化し、画素アレイのスキャナやアンプ、電圧バ イアス回路などを加えて CMOS イメージセンサを構成した. チップの試作は ams 0.35µm 2-poly 4-metal standard CMOS technology を利用した. 基板は p 型基板を用いてい る. 図 2-10 および表 2-1 に試作した埋植用自己リセット型 CMOS イメージセンサ の外観および仕様をそれぞれ示す. イメージセンサはマウス脳表への埋植を目的とし て設計しており、チップ寸法は 1050 × 3000 [µm²]の小型形状とした. チップの電極パ ッドは電源(Gnd, V_{dd})、クロック入力、アナログ出力に加え、画素中の電流制限負荷 M_b を調節するバイアス電圧 V_b の計 5 極である.



図 2-10 試作した自己リセット型 CMOS イメージセンサのチップ外観 Chip micrograph of the fabricated self-reset CMOS image sensor

表 2-1 自己リセット型 CMOS イメージセンサの仕様

S	pecification	of the	self-reset	CMOS	image	sensor
---	--------------	--------	------------	------	-------	--------

Technology	AMS 0.35 µm 2-poly 4-metal Standard CMOS process		
Supply voltage	3.3V		
Chip size	1050 $\mu m^H \times 3000 \ \mu m^V$		
Pixel type	3-Tr APS with a self-resetting circuit		
Pixel size	$15 \ \mu m^H \times 15 \ \mu m^V$		
Array size	$60^{ m H} imes 134^{ m V}$		
Photodiode type	n-well/p-sub		
Transistors per pixel	10		
Fill factor	31%		
Average power consumption	185 mW		

2.3.2 埋植用自己リセット型イメージセンサの特性評価

試作した CMOS イメージセンサの自己リセット動作を確認するため,図 2-11 に 示すような系を用いて任意の一画素の入射光強度に対する出力特性を測定した.照射 光は中央波長 525 [nm]の緑色 LED とし,光強度を段階的に変化させながらオパール 拡散板 (DFO-50C03-1, Sigma Koki)を通しセンサに照射した.センサは 13 [frames per second (fps)]で駆動させ,各光強度でそれぞれ 1,024 [frame]分の信号値を取得し,出力 平均値(Pixel output)および標準偏差(Noise level)を得た.

測定時、CMOS イメージセンサの電源電圧 $V_{dd} = 3.3 [V]$ とした.また、バイアス電 EV_b について、 $V_b < 2.0 [V]$ のとき画素中の負荷 M_b に流れる電流 I_{Mb} は過大となり、PD がリセット電圧に初期化される前に自己リセットによるリセット動作が終了してし まい、不適である. 2.0 $[V] < V_b < 2.2 [V]$ のとき、出力電圧のレンジは最大となるが、 これはリセット時にオーバーシュートが生じ、PD がリセット電圧以上に充電されて いるためであり、動作の安定性に欠き不適である. $V_b > 2.6 [V]$ のとき I_{Mb} は過小とな り、リセットに必要な時間が著しく増加するため、不適である.従ってバイアス電圧 V_b の最適値は2.2 $[V] < V_b < 2.6 [V]$ から探索し、 $V_b \approx 2.4 [V]$ とした.このとき,自己 リセットに必要な時間はおおよそ 8 $[\mu s]$ であった.イメージセンサのピーク消費電力 は 185 [mW]だった.

図 2-12, 図 2-13 に測定した出力およびノイズ量を示す. 図 2-12 より, 画素出 力は光強度が 0 から上昇するに従ってほぼ線形に増加し, 一旦閾値に達したあと, 再 び初期値から閾値までほぼ線形に上昇するという動作を繰り返し行なっており, 自己 リセット動作が期待通り実現できていることがわかる. 画素感度は全レンジに渡って ほぼ一定である. また, 図 2-13 よりノイズ量は光強度が上昇するに従って増加して いることがわかる.





A schematic image of a measurement system for the output of the image sensor





A performance of pixel output as function of the light intensity of the self-reset image sensor



図 2-13 自己リセット型 CMOS イメージセンサの照射光強度に対するノイズ特性 A performance of noise level as function of the light itensity of the self-reset image sensor

自己リセットセンサの出力は、式 (2-5) より、自己リセットの回数および初期値 から閾値までのレンジが既知であれば、測定値にそれらの乗を加算して本来の信号値 を推定することができる. 図 2-14 に画素出力(Pixel output)および推定した本来の信 号値(Estimated actual intensity)とノイズ量(Noise level)を両対数グラフにプロットした 結果を示す.ただし測定点がグラフ上で適切な間隔になるよう照射光の条件を変更し 再測定している.本実験ではセンサを 230 fps で駆動した.また、初期値及び閾値は それぞれ測定点の最小値、最大値とし、リセット回数は連続する 2 点の測定点が初期 値と閾値の差の半値以上変化している箇所として推定した.推定した信号値は幅広い レンジにおいて光強度に対して線形性を保って変化していることがわかる.またノイ ズ量も低照度領域においてはほぼ一定であるが、1×10⁶ [W/cm²]以上の領域において は自己リセット後も含めてほぼ光強度の平方根に比例して増加していることがわか る. 2×10⁷ [W/cm²]および1×10⁵ [W/cm²]近辺にノイズ量の極大点がみられるが、こ れは測定時の周囲環境由来の雑音と考えられる.これより、1×10⁶ [W/cm²]以上の領域では光 ショットノイズが支配的であり、1×10⁶ [W/cm²]以上の領域では光 ショットノイズが支配的であるとみなすことができる.

図 2-15 に推定した信号値とノイズ量から求めた信号対雑音比(Signal-to-noise ratio: SNR)を示す. Active pixel sensor (APS)などの一般的な画素を持つセンサのピーク信号 対雑音比は画素容量に蓄積可能な電荷量に制限され通常 40-50 [dB]であるが[56], [62], [63],本自己リセットセンサでは比較的小型画素にもかかわらず 60 [dB]以上のピーク 信号対雑音比を達成している. 一方で, SNR は 3 × 10⁻⁵ [W/cm²]付近で一時的に低下 しており,自己リセットのタイミングとも重なるため自己リセットによるリセットノ イズの増加と考えられるが,予想されるよりも落ち込みの幅が大きい. これは,単純 なリセットノイズ以外のノイズ成分が寄与していることを示唆しており,特に本セン サは画素部分における電力消費が大きいことから,リセット時に熱ノイズが重畳して いる可能性が考えられる.



図 2-14 自己リセット型 CMOS イメージセンサの照射光強度に対する出力特性,ノイズ特性, および変換後出力(両対数表示)

A double logarithmic graph of the pixel output, noise level, and estimated actual intensity as the function of the light intensity of the self-reset CMOS image sensor



図 2-15 自己リセット型 CMOS イメージセンサの照射光強度に対する信号対雑音比 (SNR) A performance of the signal-to-noise ratio as a function of the light intensity of the self-reset CMOS image sensor

2.4 明環境下蛍光イメージング

2.4.1 明環境におけるマウス脳神経細胞蛍光イメージング実験系

自己リセット方式による明環境下蛍光イメージングを実証するため、試作した自己 リセット型 CMOS イメージセンサを用いて背景光照射下で神経細胞に Green fluorescent protein (GFP)を発現したマウス脳スライスを観察した. 図 2-16 に実験系 の概略図を示す.実験では、神経細胞と画素の大きさがほぼ同等の大きさとなり、得 られる画像が視認しにくくなるため、イメージセンサと脳スライスサンプルの間に一 組の対物レンズを設置し、サンプルの像を 3.3 倍に拡大してセンサに投影した.この ような光学系は本評価実験のみに用いるものであり, 生体に埋植する際には不要であ る. 観察する脳スライスは 40 [µm]厚であり, 図 2-16 に示すようにスライドガラス 上に固定して用いた. GFP 蛍光の励起光源には中央波長 470 [nm]の青色 Light-emitting diode (LED) (M470L2, Thorlabs)を,背景光には多色のスペクトルを持つハロゲンータ ングステンランプ(CLS 150 XD, Leica)を用いた. また, 励起光は励起光強度を向上さ せるため平凸レンズを用いてサンプル上に集光し、背景光はオパール拡散板(DFO-50C03-1, Sigma Koki)を用いて均一光としている. さらに, 自己リセット型 CMOS イ メージセンサの画素アレイ上には黄色色素(VALIFAST YELLOW 3150, Orient Chemical)を含む吸光型蛍光フィルタを塗布し、センサ側面には迷光による予期せぬ光 電効果を抑制するため黒色レジストを塗布した.



A schematic of the experiment system for fluorescence imaging with the background illumination

2.4.2 自己リセット型イメージセンサによる撮像結果

図 2-17 (a)-(d)に撮像結果を示す. 撮像はサンプル付近において励起光強度 18 [mW/cm²]および背景光照度 16 [lx]となるよう設定し、センサの露光期間を 75 [ms]と 設定して行った.背景光照度 16 [lx]はセンサ出力のおおよそ 38,000 [DN]に相当し,1 [frame]間で数回の自己リセットを起こさせるに十分な光量である.図 3-17(a)は励起 光のみを照射した場合の撮像結果であり、蛍光のみが観察され、本実験の対照画像と なる. GFP が発現した神経細胞を白点として画像中にはっきりと確認することができ る.図2-17(b)は背景光のみを照射した場合の撮像結果であり、画像中に蛍光成分は 含まれず,光学フィルタを透過した緑色以上の波長の背景光成分による脳組織の陰影 が観察される.同等の光量を自己リセット機能のない通常のセンサに照射した場合, 画素は飽和し有意な情報を取り出すことは不可能となるが、自己リセット機能を備え た本センサでは飽和を回避して画像を得ることができている.図2-17(c)は背景光お よび励起光を同時に照射した場合の撮像結果であり、画像中には背景光による脳組織 の陰影の情報と蛍光の情報が重畳している. 背景光の強度が蛍光の強度に比べて極め て高いため(>1000 倍), 図 2-17(c)から蛍光を確認することは困難であるが, 図 2-17(d)のように図 2-17(c)と図 2-17(b)の差分を取ることで蛍光成分のみを抽出するこ とができる. 図 2-17(a)と図 2-17(d)を比較すると,背景光下で撮像した図 2-17(d) でも通常の暗環境下で撮像した図2-17(a)と同様にはっきりと神経細胞中に発現した GFP 蛍光の白点を観察することができる.これより,自己リセット型 CMOS イメー ジセンサを用いて励起光照射前後の撮像結果を比較することで、明環境下でも暗環境 下と同様に蛍光観察が可能であることを示した.

図 2-17(d)中のノイズ量は図 2-17(a)に比べて大きくなっている. このノイズは背 景光のショットノイズおよび自己リセットに伴う回路ノイズに起因しており, ランダ ムノイズであるため、加算平均処理によって低減可能である. また、図 2-17(d)中に は図 2-17(a)には見られない黒点が観察されるが、これは励起光照射前後で自己リセ ットの回数が変化した画素である. これらの画素は負の画素値を持つため簡単に特定 でき、解析から除外することができる. また、これらの画素値は自己リセット回数を 推定して補正することで本来の画素値を推定することが可能であるが、本実験では取 り扱っていない.



2.5 考察とまとめ

本章では自己リセット機能を各画素に備えた埋植用 CMOS イメージセンサを開発 し、開発したセンサを用いて明環境中でのマウス脳蛍光観察を実証した.

開発した自己リセット型 CMOS イメージセンサは,通常のセンサでは画素の飽和 が生じる高強度の照射光下でも自己リセットを繰り返すことで飽和を回避しながら 光強度を測定可能であった.センサの感度は幅広いダイナミックレンジにおいて一定 を保ち,微小な光強度変化と高強度の背景光の情報を同時に取得できた.

また、本センサは、構造上は小型の画素容量でありながら、繰り返し容量を再利用 することで実質的には大型の容量を備えた画素と等価的に働く.これにより、蓄積可 能な電荷量が増大し、高光強度下で測定を行うことで光ショットノイズ雑音を相対的 に低減することができるため、一般的な小型画素を備えた CMOS イメージセンサよ りピーク信号対雑音比を引き上げることができる.実際、一般的なイメージセンサの ピーク信号対雑音比が 40-50 [dB]であるところ、本イメージセンサは 60 [dB]以上のピ ーク信号対雑音比を示した.なお、画素のさらなる微小化には、各画素のリセット回 路を画素アレイから引き出し、素子の別領域にまとめることも考えられるが、配線距 離の増大による寄生容量の発生やクロストークによるノイズの増大が生じ、自己リセ ット機能には画素と同数の自己リセット回路が必要であり配線数も膨大となるため、 現実的ではない.

一方で画素内におけるピーク消費電力が大きく,生じる熱によってノイズ性能が損なわれていた.リセットノイズ自体も無視できないレベルで生じていた.過大な熱の 発生はイメージセンサの生体への埋植時に侵襲性が増大することにもつながるため,可能な限り抑えなければならない.この点については次の章で取り組む.

また、開発した自己リセット型 CMOS イメージセンサを用いて、背景光下において マウス脳神経細胞中に発現した GFP 蛍光が検出可能であることを実証した.一般的 な CMOS イメージセンサや自己リセット以外の広ダイナミックレンジ方式[50]-[53] を用いたイメージセンサでは、重畳した GFP 蛍光と背景光の強度比があまりに大き すぎるため、露光時間を調節するなどしても、背景光にレンジを合わせれば蛍光成分 が検出限界を下回り、蛍光にレンジを合わせれば画素が飽和して測定不可能となる. 自己リセット方式は広ダイナミックレンジかつほとんどのレンジで感度が一定であ るため、従来きわめて困難であった背景光と微弱蛍光の輝度情報の同時取得に成功し た.蛍光輝度の取得も背景光下で励起光照射前後の差分をとるだけの簡素な処理であ り、励起光とセンサの同期がとれるシステムであれば簡単に応用できる.本方式は明 暗変化する環境下における自由行動下小動物の脳機能変化を継続的に測定可能な技 術として応用可能であり、今後生体の概日リズムに伴った記憶形成過程の解明や覚醒 時と睡眠時の脳活動の関連性の解明などが期待される.

第3章 低消費電力型自己リセットセンサによる高信号 対雑音比脳機能イメージング

3.1 はじめに

光学的手法による脳神経活動計測[21], [64]は電気生理学的手法[30], [31]に比べ時間 分解能や空間分解能に優れ,多数の神経細胞を同時に計測することができるなどの長 所を持つ[65].一方で,多くの場合,光学的な神経活動計測には神経細胞への蛍光標 識の注入[13]や遺伝的導入[39], [66], [67]が必要となる.生体への蛍光標識の導入はし ばしば煩雑な実験手順を踏まねばならず,その応用範囲を制限する要因の一つとなっ ている.神経活動に伴って,神経細胞の周囲では血流量変化[17]や血中ヘモグロビン の酸化還元反応に伴う吸光度変化[16], [43]が観察される.このようなヘモグロビン動 態に伴う光学的計測が可能な変化は生体一般にみられ,内因性信号と呼ばれる.内因 性信号は生体の標識など複雑な実験準備を行う必要がないため,脳機能の有力な計測 法の一つである.

しかし、内因性信号は微弱であり、その光学的な観察には計測装置に工夫が求められる. 例えば、本章の実験で用いるようなオレンジ光(λ=605 [nm])に対するヘモグロ ビン動態に伴う吸光度変化は 1%以下であり、測定には信号対雑音比(SNR) ~ 60 [dB] が求められるが、一般的な CMOS イメージセンサの信号対雑音比は 40-50 [dB]であ り、このようなセンサを用いて埋植可能な脳機能イメージングデバイスを構成するこ とは困難である.

そこで本章では、内因性信号の検出が可能な埋植型イメージングデバイスの実現を 目標とし、高信号対雑音比を実現する CMOS イメージセンサの開発および、開発した センサを用いたマウス生体脳中における内因性信号のイメージングの実証を行った. 高信号対雑音比イメージセンサの実現には、前章で信号対雑音比の向上が示唆された 自己リセット方式を改良して用いた.本章で開発する自己リセット型 CMOS イメー ジセンサは、前章で開発した自己リセット型 CMOS イメージセンサと区別するため、 以降は低消費電力型自己リセットセンサと呼称する.また、神経活動に伴う内因性信 号の検出は、開発した低消費電力型自己リセットセンサを埋植デバイスに組込み、マ ウス脳表面の一次体性感覚野に埋植したうえで、マウスの前肢および後肢を電気刺激 した際のヘモグロビン動態を観察することによって行った.なお、本章の内容は学会 要旨[68]および論文[69]に基づいている.
3.2 神経活動に伴う内因性信号の発現機構

神経活動が生じると、神経細胞内でエネルギー消費が生じ、グルコースや酸素が消 費される. それに伴い、神経系や周囲の血管には神経活動を生じた細胞に速やかに酸 素やグルコースを補填する機構が存在する[70].図3-1に脳内におけるエネルギー供 給・消費の経路図と、それに伴う血流制御機構を示す。神経細胞やグリア細胞 (Astrocyte)が他神経細胞のシナプスから神経伝達物質を受けると、各細胞中のイオン チャネルが応答し、細胞壁内外のイオン濃度差が変化して神経細胞が興奮する. イオ ンチャネルの駆動にはエネルギーが必要なため、細胞内の解糖系やミトコンドリアで 酸素とグルコースが消費され、アデノシン三リン酸(ATP)としてイオンチャネルに供 給される. それと同時に, 一酸化窒素(NO)やアラキドン酸(AA)といった伝達物質が細 胞外に放出され、細胞周囲の血管の平滑筋を能動的に制御する.これにより、神経細 胞の興奮に伴って速やかに周辺血管の一時的な膨張が生じる.このとき、毛細血管内 の容積変化はごくわずかなのに対して、より上流の太い血管はより大きく容積変化を 起こすため、上流血管内の血流量増大に伴って毛細血管内では血流速が増大し、毛細 血管内の低酸素飽和度の血液は動脈の高酸素飽和度の血液に置換される[44].以上の 機構により,神経活動が生じた神経細胞周囲の毛細血管中では酸化型ヘモグロビンが 増大し、還元型ヘモグロビンが減少する. 増大した酸素量は神経細胞で消費された酸 素量以上のものとなる.



図 3-1 脳内における神経系のエネルギー供給と消費,および血流制御 Energy supply, usage and blood flow regulation in the brain [D. Attwell *et al.*, *Nature*, vol. 468, no. 7321, pp. 232–243, 2010]

ここで、酸化型ヘモグロビン(HbO)と還元型ヘモグロビン(HbR)の吸光スペクトル [43]を図 3-2 に示す.図には、ヘモグロビン動態の光学的な観察によく用いられる 3 色の LED (λ = 530, 605, 630 [nm])の発光スペクトルも付記されている.緑色 LED (λ = 530 [nm])の波長域では酸化型ヘモグロビンと還元型ヘモグロビンの吸光度はほぼ変 わらないため、緑色 LED を光源として脳組織の吸光度変化を観察すると血液の体積 に強く相関した信号を得ることができる.また、橙色(λ =605 [nm])や赤色(λ =630 [nm]) の LED の波長域では還元型ヘモグロビンの吸光度の方が酸化型ヘモグロビンの吸光 度よりも大きくなるため、この波長域のLED 光源を用いて観察すると血中の酸素濃 度に強く相関した信号を得ることができる.



図 3-2 酸化型ヘモグロビン(HbO)および還元型ヘモグロビン(HbR; 図中では Hb)の吸光スペクトルおよび LED (λ = 530, 605, 630 [nm])の発光スペクトル

In vitro absorbance spectra for HbR and HbO along with normalized emission spectra for the three LEDs ($\lambda = 530, 605, 630$ [nm]).

[Y. Sirotin et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 106, no. 43, pp. 18390-5, 2009.]

実際にそれぞれの LED で脳表面の神経活動に応じた吸光度変化を観察すると,図 3-3のような内因性信号を得ることができる[43]. それぞれ,生体への刺激直後から 対応した脳領域で 10 秒程度のスケールの吸光度変化が生じている.緑色 LED の場合 は刺激から 2.9 [s]で 3.3%信号値が下降(吸光度が増大)し,橙色 LED では刺激から 1.5 [s]で一時的に 0.31%信号値が下降した後,3.7 [s]で 0.69%信号値が増大している. 赤色 LED も刺激から 1.3 [s]で一時的に 0.05%信号値が下降した後,3.6 [s]で 0.49%信 号値が増大している.これは,緑色 LED による観察では神経興奮に伴う血流量の増 大が吸光度の増加として観察され,橙色および赤色では酸化型ヘモグロビンに対する 還元型ヘモグロビンの相対的な比率の減少が吸光度の減少として観察されているこ とを意味する.なお,従来は橙色および赤色 LED で観察される一時的な吸光度の増 大"Initial dip"が神経細胞の酸素消費による還元型ヘモグロビンの増大を示していると 考えられていたが,血流量変化と酸素飽和度の変化をより厳密に解析した研究により, "Initial dip"は時間応答が僅かに早い血流量変化の信号成分が橙色や赤色の LED でも 重畳して観察されることによる偽信号であると指摘されている[43].

本章の実験では、より生体由来のアーティファクトが小さく、比較的反応の大きい 橙色 LED を照射光として用いた.緑色 LED の波長帯は血中成分の吸光度差が大きい ため血流そのものが大きなノイズとなり、解析には血管部分をマスクするなどの処理 が必要となる.また、赤色 LED の波長帯は反応が比較的小さく、観察に適していな い.





3.3 低消費電力型自己リセットセンサの開発

前章では自己リセット型 CMOS イメージセンサを開発し、一般的な CMOS イメージセンサでは困難な、幅広いダイナミックレンジにおいて線形性の高い出力特性と、高光強度下における高い信号対雑音比の両立が示された.一方で、開発した自己リセット画素は消費電力が高く、発熱によって信号対雑音比が損なわれている可能性が示唆された.イメージセンサを生体に埋植する上では、センサの発熱が生体組織に与えるダメージも懸念される.

そこで、本節ではまず従来の自己リセット画素回路を見直し、画素の低消費電力化 に向けた方策を示す.次に画素回路およびイメージセンサの具体的な設計を示し、試 作したイメージセンサの評価について述べる.最後に従来の自己リセット型イメージ センサと比較し、低消費電力型自己リセットセンサの有用性を示す.

3.3.1 第2章で開発した自己リセット画素のノイズ解析

まず,第2章で試作した自己リセット型イメージセンサの出力特性を考察する.式 (2-1)および式(2-4)より,自己リセット型イメージセンサのノイズ量のSELFRSTは

$$\sigma_{SELFRST} \simeq \sqrt{(N+1)\sigma_{RST}^2 + S^2 \cdot n} \cdots 3-1$$

であるから、 $\sigma_{SELFRST}$ は暗時のランダムノイズ σ_{RST} とリセット回数N、ゲインS、およびフォトキャリア数nから計算することができる.

一方で、図 2-14 の横軸は照射光強度 I_L [W/cm²]であるが、これは以下の式からフォトキャリア数nに変換することができる.

$$n \qquad = \qquad I_L \cdot \frac{\lambda}{h \cdot c} \cdot \frac{Sr_{pix}}{F} \cdot Q$$

ただし λ は照射光の波長[m], hはプランク定数 6.626×10^{-34} [J·s], cは光速 2.998×10^8 [m/s], Sr_{pix} は画素面積[cm²], Fはフレームレート[1/s], Qは量子効率. 第 2 章の自己 リセット型イメージセンサの場合, $\lambda = 5.25 \times 10^{-7}$ [m], $Sr_{pix} = 6.97 \times 10^{-7}$ [cm²], F = 229 [1/s]である.また,量子効率Qは不明であるため,一般的な Si 半導体の波長 525 [nm]における量子効率 0.3 を用いる.以上より,式(3-1)より推定される理論式 と第 2 章 3 節 2 項で測定した実際の自己リセット型イメージセンサの偏差を比較する と,図 3-4 のようになる.ただし理論式について,リセットノイズ σ_{RST} は $I_L = 6.6 \times$ 10^{-7} [W/cm²]以下の測定点の平均値, ゲインSは測定点における変換した出力信号値 V_{sig} のうち最も大きな値とそのときのフォトキャリア数nから算出し, リセット回数N は測定値の出力信号値 V_{SRout} の最大値・最小値から求めた出力信号振幅 V_{SWING} を用い て計算した.



図 **3-4** 自己リセット画素のフォトキャリア数に対するノイズ量 Noise level versus photocarrier of the self-reset pixel

図 3-4 より, 第3章で開発した自己リセット画素は特に高照度下(フォトキャリ ア数10⁴以上)の領域で予想されるノイズ量よりも著しく高いノイズ量となっている ことがわかる.フォトキャリア数の増加に対するノイズ量の上昇の傾向も理論値とは 異なり,高照度下ではリセットノイズや光ショットノイズ以外に由来するノイズが重 畳していると推測される.

ここで、自己リセット画素の回路図(図2-4)およびタイミングチャート(図2-5)をみると、画素内容量の電圧V_{PD}が低下するに従って、Schmitt trigger インバータ回 路内の電流I_{s1}, I_{s2}が10 [µA]以上の値となったり、自己リセット時にリセット回路内 の電流I_{MD}が1 [µA]以上となるなど、微小な画素回路面積で大きな電力消費が生じて いることがわかる.これは画素内での局所的な温度上昇につながることが懸念される. 実際、第2章で開発した自己リセット型イメージセンサはV_{PD}が一定以上低下する高 光強度下ではチップレベルでの消費電力が185 [mW]となり、水中でも100℃以上にな るほど過熱した.このような温度上昇は、画素容量や画素回路において単純な熱雑音 の増加だけでなく暗電流の増加にもつながり[71]、測定の精度・正確性に悪影響を及 ぼしていることが予想される.また、生体にも著しい損傷を与えるため、自己リセッ ト画素回路中で生じているこれらの短絡電流の抑制は急務である.

そこで、本研究では第2章で開発した自己リセット画素回路を改良し、低消費電力 型自己リセット画素を開発した.

3.3.2 自己リセット画素回路の低消費電力化

本章で開発した低消費電力型自己リセット画素は、特に Schmitt trigger インバータ 回路内やリセット回路内で非定常的に生じる貫通電流の抑制を目的とした.図 3-5 に低消費電力型自己リセット画素の画素回路を示す.



図 3-5 低消費電力型自己リセット画素回路 A schematic of the low-power consumption self-reset pixel circuit

低消費電力型自己リセット回路では、貫通電流 I_{s1} , I_{s2} を抑制する目的で Schmitt trigger インバータの電源電圧 V_{STI} を可変とし、さらにリセット回路の電流 I_{Mb} を抑制す るために p 型トランジスタ M_{st} を付加した.回路構成変更の詳細は付録(自己リセッ ト画素回路の遷移過程と低消費電力化の方策)にて述べている.簡潔にまとめると、 従来の自己リセット回路では、貫通電流は画素容量の電圧 V_{PD} が 1.6 [V]前後にあると き、Schmitt trigger インバータ中の全ての MOS トランジスタのゲート-ソース間が導 通状態となるため生じていた.Schmitt trigger インバータの出力 V_{SR} が反転を起こす電 圧付近まで M_{p1} のゲート-ソース間を遮断状態に保てられれば、動作上も問題なく貫通 電流を抑止することができる.すなわち、 V_{SR} が反転を生じる最低電圧は n 型トラン ジスタの閾値電圧 V_{TN} 程度であるから、 M_{p1} のゲート電圧 V_{STI} が V_{TN} + $|V_{TP}| \simeq 1.5$ [V]程 度であれば V_{pD} が自己リセットの閾値に達するまで十分 M_{p1} のゲート-ソース間を遮断 状態に保つことができ、貫通電流を抑止することができる.一般的にはこのような貫 通電流の抑止は飽和領域で動作する MOS トランジスタを高抵抗値の負荷として貫通 電流の経路に加えることで行うが、本回路ではトランジスタ数を可能な限り抑制する ため、上記のような手法を採用している.また、回路設計上 V_{STI} はセンサ外部から調 整が可能な仕様とした.

図 3-6に自己リセット画素回路で用いている Schmitt trigger インバータの電源電圧 V_{STI} に対する消費電力の SPICE シミュレーションの結果を示す.図 3-6 から,この インバータの消費電力は、電源電圧 V_{STI} を下げることにより、指数関数的に抑制させ られることがわかる.付録(自己リセット画素回路の遷移過程と低消費電力化の方策) や SPICE シミュレーションの結果から、理想的には V_{STI} は 1.5 [V]程度まで下げること ができるが、実際には動作電圧の揺らぎやトランジスタの閾値電圧のばらつきにより 画素動作の不安定性が無視できないレベルになるため、 $V_{STI} = 1.7$ [V]と設定して以降 の実験を行った.この場合でも、 $V_{STI} = 3.3$ [V]であった従来に比べ 1/600 程度への低 消費電力化が期待できる.



図 3-6 4-Transistor 型 Schmitt trigger インバータ回路の電源電圧に 対する消費電力の SPICE シミュレーション結果 Simulation result of power consumption of the 4-Tr Schmitt trigger inverter as function of power supply voltage

図 3-7 に従来の自己リセット画素回路と低消費電力型自己リセット画素回路の画素内電圧および電流について、過渡応答の SPICE シミュレーションを行い比較した結果を示す.図 3-7 より、画素容量の電圧 V_{PD} が正常に自己リセット動作を行いながら、電流 I_{s1} , I_{s2} を効果的に抑制できていることがわかる.電流制限のために設けたトランジスタ M_{st} も I_{Mb} のピーク電流を効果的に抑制できた.また、画素全体の SPICE シミュレーションより、画素の平均消費電力を 0.15 [μ W/pixel]に低減できることが分かった.



図 3-7 従来自己リセット画素と低消費電力型自己リセット画素の画素内電圧・電流の比較 Comparison for the internal voltages and currents of the previous self-reset pixel and the low-power consumption self-reset pixel

3.3.3 低消費電力型自己リセットイメージセンサのチップ設計

第2章3節1項と同様に、前項で設計した画素回路をアレイ化し、周辺回路を付加 してイメージセンサを構成した.第2章との詳細な変更点は付録(自己リセット画素 回路の遷移過程と低消費電力化の方策)に示している.低消費電力型自己リセット画 素のレイアウト図、低消費電力型自己リセットセンサのチップ外観、およびセンサ仕 様を、それぞれ図3-8、図3-9、表3-1に示す.画素は従来と同じ15×15 [μ m²]の 外形寸法で、画素内トランジスタ数は11である.トランジスタを追加したため受光 部のフィルファクターは31%から26%に減少した.チップサイズは1050×3000 [μ m²] であり、電極パッドは電源(Gnd, V_{dd})、クロック入力、アナログ出力、バイアス電圧 V_b に加え、リセット電圧 V_{rst} とインバータ電源電圧 V_{sTI} の計7極である









表 3-1 低消費電力型自己リセットセンサの仕様

Specification of the low-power consumption self-reset image sensor

Technology	AMS 0.35 µm 2-poly 4-metal Standard CMOS process
Supply voltage	3.3V
Chip size	$1050~\mu m^{\rm H} \times 3000~\mu m^{\rm V}$
Pixel type	3-Tr APS with a self-resetting circuit
Pixel size	$15 \ \mu m^H \times 15 \ \mu m^V$
Array size	$60^{ m H} imes 120^{ m V}$
Photodiode type	n-well/p-sub
Transistors per pixel	11
Fill factor	26%
Average power consumption	20 mW

3.3.4 低消費電力型自己リセットセンサの特性評価

試作した低消費電力型自己リセットセンサの動作を確認するため,第2章3節2項 と同様にして出力特性を測定した.本実験では,イメージセンサはフレームレート49 [fps]で動作させ,電源電圧 V_{dd} = 3.3 [V],バイアス電圧 V_b = 2.6 [V],リセット電圧 V_{rst} = 2.0 [V], Schmitt trigger インバータ電源電圧 V_{STI} = 1.7 [V]とした.このとき,チ ップ全体での平均消費電力は20 [mW]となり,従来の185 [mW]から90%近い改善が 見られた.消費電力の大部分は画素以外の周辺回路でのものとなっている.

図3-10に画素出力(Output signal)および推定した本来の信号値(Reconstructed signal) とノイズ量(Noise level)の測定結果を示す.図3-10から,本センサでも,リセット閾 値(Reset level)に達するまで照射光強度に比例して線形に出力信号が増大し、リセット 閾値到達後は再び初期値から照射光強度に従って出力信号が増大するという自己リ セット動作が実現できていることがわかる.自己リセット後も画素の感度はほとんど 変わらないため,本センサでも第3章と同様に出力信号値を式(2-5)に従って補正 したところ,幅広いレンジで照射光強度に線形に比例する信号値が得られている(図 3-10 Reconstructed signal).



図 3-10 低消費電力型自己リセット画素の照射光強度に対するセンサ出力とノイズ量 Signal and noise intensities of the low-power consumption self-reset pixel

3.3.5 出力特性の従来画素および理論式との比較

本章で開発した低消費電力型自己リセット画素と第2章で開発した自己リセット 画素,およびそれぞれの理論式を比較する.

まず,それぞれの感度特性を図 3-11 に示す.理論値は式 (3-3) に基づいている. 従来の自己リセット画素と低消費電力型自己リセット画素の変換ゲインは,仮定を含 むため不正確ではあるが,それぞれおおよそ 10 [µV/e]および 3 [µV/e]であった.低消 費電力型自己リセット画素は従来の自己リセット画素に比べ受光部のフィルファク ターが減少し,また出力電圧のスイング幅が制限されているため,感度が小さくなっ ている.しかし,自己リセット画素は高光強度下での使用を前提としているため,感 度の低さは特に問題とならない.また,低消費電力型自己リセット画素はフォトキャ リア数 1×10⁵以下の領域で比較的感度が低い.これは付録(自己リセット画素回路の 遷移過程と低消費電力化の方策)に示す通り,低消費電力型自己リセット画素では従 来からソースフォロワアンプの構成を変更したが,このアンプの出力の線形性が十分 ではないことが影響したと考えられる.これについても比較的低光強度下での問題で あるため,実用上は特に問題とならないが,出力の線形性を補正する回路を付加する などの対策が考えられる.



因 5-11 画楽山刀の比較(SK-pix: 従来自己リビット画案, LPSR-pix: 低消費電力型自己リセット画素, Exp.: 実測値, Theory: 理論値)

Comparison of the pixel outputs (SR-pix: Previous self-reset pixel, LPSR-pix: Low-power consumption self-reset pixel, Exp.: Experimental value, Theory: Theoretical value)

次に,図 3-12 に従来の自己リセット画素と低消費電力型自己リセット画素のノイズ量の実測値および理論値を示す.理論値は式(2-4)に基づいている.図 3-12 から,従来の自己リセット画素に比べ低消費電力型自己リセット画素の実測値はより理

論値に近い傾向となり,値の差も小さくなっていることがわかる.低消費電力化により画素の発熱が抑制され,熱起因のノイズが大きく減少したと考えられる.ただし,低消費電力型自己リセット画素の実測値はフォトキャリア数1×10⁴以上の領域で理論値から乖離する傾向にあり,また自己リセット直後の領域ではノイズの減少がみられる.これは本質的にノイズ量が減少しているのではなく,低光強度領域での感度の低さにより見かけ上他の領域よりもノイズが減少して観察されているためと考えられる.



図 3-12 ノイズ量の比較(凡例は図 3-11 に従う) Comparison of the noise level (Captions follow fig. 3-11.)

最後に、図 3-13 に従来の自己リセット画素と低消費電力型自己リセット画素の信 号対雑音比(SNR)の実測値および理論値を示す.理論値は式(2-8)に基づいてい る.図 3-13 から、従来の自己リセット画素に比べ低消費電力型自己リセット画素の 実測値はより自己リセット後の SNR 向上が理論値に沿った傾向となっており、フォ トキャリア数 1×10⁵以上の高光強度下では従来の自己リセット画素の SNR を超え、 ピーク SNR では 70 [dB]を達成している.

以上から,自己リセット画素を低消費電力化することにより,従来よりもピーク SNRの高いイメージセンサを開発することに成功した.また,低消費電力化に伴って 発熱も抑制することができており,センサの埋植においてより生体組織へのダメージ を軽減できることが期待される.さらに,低消費電力化は将来の無線電力伝送やバッ テリー駆動による省配線化の際にも,回路規模やデバイス規模の縮小に有利に働く.



Comparison of the SNR (Captions follow fig. 3-11.)

3.4 低消費電力型自己リセットセンサ搭載の埋植デバイス

開発した低消費電力型自己リセットイメージセンサを用いてマウス生体脳の内因 性信号を測定するため、自己リセットセンサを搭載する埋植用イメージングデバイス を製作した.本デバイスの実装方法は先行例[26]-[29]に基づく.以下に実装プロセス の概略を示す.

- 1) イメージセンサチップ外形の切り出し.
- 2) イメージセンサチップおよび LED のフレキシブル基板上への固定.
- 3) 基板配線と素子電極のボンディング.
- 4) エポキシ樹脂によるワイヤ配線の固定.
- 5) パリレン樹脂によるデバイスの封止.
- 1) イメージセンサチップ外形の切り出し.

Austria Micro Systems (ams)社より納品されたイメージセンサチップを設計上のセンササイズ(3000×1050µm²)に切り出した.切り出しにはダイシング装置(A-WD-10B, ACCRETECH)を用い,ダイアモンドカッタによる物理的な研削加工を行った. 先行研究[26]では DRIE (Deep Reactive Ion Etching)を用いたドライエッチングによる外形加工法が提案されているが,本研究では切り出しの要求精度が比較的低いため,プロセスがより簡略な研削加工を用いた.

- 2) イメージセンサチップおよび LED のフレキシブル基板上への固定. 切り出したイメージセンサチップおよび既製の LED チップ(SML-P12DT, Rohm; λ = 605 nm)をフレキシブル基板(FPC)上にエポキシ樹脂(EPOTEK 730, Epoxy Technology)で固定した. チップのアライメント等は顕微鏡下でマニュアルにより 行った.
- 3) 基板配線と素子電極のボンディング. ウェッジワイヤボンダ(7700CP, West bond)を用いてフレキシブル基板の配線と LED およびセンサチップの電極を接続した.接続には 25 µm 径の Al ワイヤを用い,超音波接合により金属材料同士を融合させ高い強度と電気的安定性を実現する.本手法は産業界における半導体のパッケージング工程で一般的な手法である.
- 4) エポキシ樹脂によるワイヤ配線の固定.
 基板の配線と素子の電極をつなぐワイヤは空中に浮いた状態となるため、このままでは埋植時などに突起物と接触してワイヤが切断されるなど脆弱である。そのため、ワイヤとフレキシブル基板間およびワイヤ表面をすべてエポキシ樹脂で埋め、ワイヤの変形によりデバイスに不具合が生じる余地をなくした。
- パリレン樹脂によるデバイスの封止. 最後にデバイス全体を成膜装置(PDS 2010, Specialty Coating Systems)の真空チャン

バ内に吊るし, Parylene-C を 2µm の厚さで蒸着した. Parylene-C は化学気相成長 法(CVD)によって自由形状表面にピンホールなく均一に成膜可能な有機ポリマー であり,透水性や透気性,導電性が低いため,比較的簡単にデバイスに防水性や 絶縁性を付与することができる. さらに, Parylene-C は米国薬局方(United States Pharmacopeia; USP)より生体適合材料の分類 IV として認定されるなど高い生体適 合性を持ち,埋植部の全表面にコーティングすることでデバイスに生体適合性を も付与することができる.

上記プロセスにより,図3-14に示す埋植用イメージングデバイスを製作した.搭載した LED はすべて直列接続している.本デバイスの測定対象は吸光度変化を生じる内因性信号であるため,先行研究[26],[27],[29],[55]にあるようなカラーフィルタは搭載していない.また,センサは自己リセット機能により高い光強度下でも撮像が可能であるため,センサ側面からの迷光は顕著な問題となりにくく,今回は特段の遮光措置をしていない.このように,本デバイスは撮像対象とセンサ動作の工夫により, 簡素な実装でも脳機能計測が可能な構造を実現している.



図 **3-14** 実装した埋植用イメージングデバイスの埋植部 Implant part of the fabricated implantable imaging device

3.5 内因性信号イメージング実験

3.5.1 実験動物の準備とイメージングデバイスの埋植

本研究の動物実験は奈良先端科学技術大学院大学の動物実験等の実施に関する規 定に準拠して行った.埋植手順は基本的に先行研究[28],[72]に沿っている.実験動物 には成熟マウス(C57BL6, wild type)を用いた.また,マウスは実験開始前に 10%ウレ タン麻酔(カルバミン酸メチルを生理食塩水で希釈)の腹腔投与(1.0g/kg)により麻酔 した.まず,マウス頭部をステレオタキシック装置(SR-5M, Narishige)に固定し,マウ ス腹部をヒータにより保温した.次に,脳地図[37]を参考に,前肢に係る一次体性感 覚野を中心として頭皮および頭骨を除去し,脳表面を露出させた(図 3-15).このと き,脳表面の硬膜は撮像にほとんど影響せず,また除去に伴って脳表面の損傷や炎症, 出血などを伴う恐れがあったため,今回は取り除いていない.その後,埋植型イメー ジングデバイスのセンサ部を脳表面に直接接触させた(図 3-16).デバイスと脳表面 はデバイス上に湿らせた拭き取り紙などを重しとして載せることで仮固定した.



図 **3-15** 麻酔下マウスへのイメージングデバイスの埋植 Implantation of the imaging device for an anesthetized mouse



(左) 模式図 (右) 施術中の写真 Implantation of the implantable imaging device for the mouse brain surface

(Left) schematic image (Right) photograph image

図 3-17 に埋植デバイスによって撮像した領域の顕微鏡像を示す.また,図 3-18 にマウスの脳地図と今回撮像した領域に相当する領域を示す.図 3-18 より,撮像した領域は前肢に関わる1次体性感覚野を含み,それ以外の主要な領野を含んでいない領域となっていることがわかる.



図 3-17 撮像領域の顕微鏡像 Micrographic image of the captured area



図 3-18 脳地図と撮像領域

(FLS1: Forelimb area of the primary somatosensory cortex, HLS1: Hindlimb area of the primary somatosensory cortex, BCS1: Barrel cortex area of the primary somatosensory cortex, PTA: Parietal association area, M1: Primary motor cortex)
 Brain map and the captured area
 Modified from [D. H. Lim *et al.*, *Front. Neural Circuits*, vol. 6, p. 11, 2012].

3.5.2 脳表面の撮像と自己リセットセンサ出力の復元

埋植したイメージングデバイスを中継基板や制御基板,電源系,PC に接続し,脳 表面の撮像を試みた.図3-19 にイメージングシステムのブロックダイアグラムを示 す.使用した中継基板や制御基板は基本的に先行研究[29]で使用したものと同等であ る.イメージングデバイスは PC により制御され,任意のフレームレートで動作させ ることができる.今回の実験ではフレームレート 40.6 [fps]で撮像した.画像データは 制御基板内でアナログ信号からデジタル信号に変換され,PC の制御プログラム(C++) で記録される.



図 3-19 埋植実験に用いたイメージングシステムのブロックダイアグラム Block diagram of the imaging system for the implantation experiment

LED の光強度を画像中心部で5回前後の自己リセットが生じる程度に設定し, 脳表面を撮像した結果を図3-20に示す.図3-20より,低消費電力型自己リセットセンサにより撮像した脳表画像は顕微鏡像(図3-17)とは大きく異なり,画面中に複数の縞模様が観察されることがわかる.この縞模様は画面内の光強度ムラにより自己リセット回数が異なっているために生じており, 縞模様の境界を挟んで画素値の最高値付近と最低値付近をとっているものの,実際の光強度差はごくわずかである.



図 3-20 マウス脳表面の撮像結果 Captured image of the mouse brain surface

ここで、第2章の式(2-5)より、画素値のスイング幅 V_{SWING} とリセット回数Nが 既知であれば、本来の光強度に応じた出力 V_{sig} が得られることがわかる。それぞれの 画素のスイング幅 V_{SWING} は事前のキャリブレーション等によって決定することがで きる。ところが、本自己リセットセンサは自己リセット回数Nのカウント機能を持た ず、Nが不明であるため、 V_{sig} は得られない。

そこで、カウント機能を持たない自己リセットセンサでも本来の光強度に応じた出 力Vsigを測定するため、次のようなキャリブレーション手順を考案した.まず、LED 光の強度以外の撮像条件を実際の実験条件に揃え, LED 光の強度をゼロにセットして 撮像を開始する.次に,LED光の強度を十分にゆっくりと上昇させる.最後に,測定 に必要な光強度まで上昇させ、実際の神経活動計測に移る.このようにすることで、 初期状態から自己リセット回数の変化を追って数え上げることで、Nを推定可能とな る. 自己リセット回数の変化は各フレーム間で画素値がV_{SWING}/2以上変化した場合を 検出し、変化量の符号からカウントアップまたはカウントダウンを判断する. 脳表面 で生じる生理現象起因の光強度の変化は数%と微弱であり、フレームレートに比べて +分にゆっくりと生じる.また,LED 光の強度も十分にゆっくりと変化させている. このため、急激な光強度変化による自己リセット回数のカウント誤りはほとんど考慮 せずに済む.図 3-21 に、上記キャリブレーション法に従って任意の一画素の出力を 補正した結果を示す.ただし、V_{SWING}は測定データ中の画素値の最大値および最小値 の差とした.図3-21に示すように、安定した補正が可能である.このようなキャリ ブレーションが適用できるのは、脳機能イメージング時のセンサに入射する光強度が 完全にコントロール可能なためである.





上記のキャリブレーション法を全画素に適用するため、自己リセット出力の補正プログラム(MATLAB)を作成した. 図 3-22 に、補正プログラムによって推定した図 3-20 に対する自己リセット回数Nの推定マップを示す. さらに、図 3-23 に、図 3-20 および図 3-22 から補正した画像を示す. 図 3-23 から、上記キャリブレーションを実行することで、カウント機能を持たない自己リセットセンサであっても通常のセ

ンサで撮像した図 3-17 の顕微鏡像ような画像が得られることが示された.図 3-17 と図 3-23 を比較すると,図 3-23 は血管像がややぼやけたような印象を受けるが, これは撮像に用いた光源が図 3-17 では白色光であるのに対して,図 3-23 は橙色 LED の単色光であり,脳組織と血管や血中物質のコントラスト差が低くなるためであ る.より短波長の光を用いればより明瞭な画像が得られる.



図 3-22 図 3-20 に対する自己リセット回数の推定マップ Estimated reset count map of the self-reset image (fig. 3-22)



図 3-23 図 3-20 および図 3-22 から推定した脳表面画像 Brain surface image estimated from fig. 3-20 and fig. 3-22

3.5.3 体性感覚刺激に応じた神経活動の測定

次に、体性感覚刺激に応答するマウス脳の内因性信号の検出を試みた.撮像領域は 前述の通り、マウス脳地図上で前肢に関わる一次体性感覚野に相当する領域である. また、本実験にあたってマウスの前肢および後肢に図 3-24 に示す刺激電極を取り付 けた.さらに、刺激電極には電気刺激装置(SEN-3301, Nihon Kohden)および信号絶縁器 (SS-202J, Nihon Kohden)を取り付け、図 3-25 に示すシーケンスでマウスの前肢およ び後肢を刺激した.刺激時の印加電流は、パルス幅 1 [ms]、パルスインターバル 250 [ms]、1 [mA]とし、一度の刺激で 12 パルスを与えた.図 3-26 に電気刺激システムの 概略図を示す.シーケンスの"Start"および"Stimulation Start"時にトリガ信号が制御基 板へ送られ、画像とともに記録される. "Stimulation stop"から"Finish"までは 143~173 [s]のランダムなインターバルが設定され、同期ノイズやマウスのタイミング学習など によるアーティファクトを回避する.通常、このシーケンスを 10 回程度繰り返して 1 回の実験とする.



図 3-24 刺激電極 Stimulation electrode



Sequence for the electrical stimulation



図 3-26 電気刺激システム Electrical stimulation system

図 3-27 にマウスの前肢を刺激した際に低消費電力型自己リセットセンサを搭載 したイメージングデバイスで得られた脳表の光強度変化を示す.画像は刺激直後から 1 秒ごとに抜き出して列挙しており,0.4~1%の変化を赤色で,-0.4~-1%の変化を青色 でオーバーレイし強調表示している.また,本画像は電気刺激 10 回の試行平均であ り,生体の自発活動などのアーティファクトを低減している.図 3-27 から,刺激開 始のおよそ4 秒後をピークとして画面全体で光強度の変化が観察されることがわか る.特に,画像の上部の領域が他の領域よりも強い反応を示しているが,画像の上部 がちょうど脳地図で示された前肢に関わる一次体性感覚野(FLS1)である.

オーバーレイした変化率の分布について、特に4秒後前後の画像では、高い変化率 が期待されるにも関わらず 0.4%以上の変化を示していない(赤色で強調表示されて いない)線状の領域が多数みられる.これはちょうど図 3-20 における自己リセット の境界部分にあたっている.本章で開発した低消費電力型自己リセット画素は出力の 線形性が十分でなく、特に画素値が小さい領域での感度が低くなっているため、感度 一定を前提として処理した図 3-27 のような画像では補正前の画素値が小さい領域 で相対的に変化率が小さく算出されてしまっていると考えられる.観察領域全域で正 確な変化率を算出するためには、センサ自体に出力線形性を補正する回路を備えるか、 全画素のキャリブレーションを行ってポストプロセッシングにより線形性を補正す る必要がある.また、回路寸法やバイアス電圧の設計が不適切である可能性も考えら れるため、回路設計の見直しも必要である.自己リセット閾値のぶれも補正後の出力 線形性に影響するため、自己リセット機構の安定性もさらなる検討が必要である.



図 3-27 前肢刺激後の脳表における光強度変化 Light intensity change of the brain surface after the forelimb stimulation

また,対照実験として同条件で後肢を刺激した際の光強度変化を図 3-28 に示す. 図 3-28 より,後肢刺激時にはほとんど光強度変化が観察されないことがわかる.ただし,刺激後 3 秒後前後の画像には血管に相当する部分などにわずかな光強度変化がみられる.これは,後肢に関する体性感覚野が観察領域に隣接しているため,血管などへモグロビン動態がより顕在化しやすい部分で隣接する脳領域の影響が表れているのだと考えられる.

以上より,体性感覚刺激に伴って対応する脳領域周辺のみで顕著な光強度変化が観察され,低消費電力型自己リセットセンサおよびそれを搭載した埋植デバイスを用いてマウスの脳神経活動に関連した内因性信号の測定に成功したといえる.





さらに、自己リセットセンサで測定した信号の測定精度を通常のイメージセンサと 比較する.自己リセット画素は光強度が初回の自己リセットの閾値に達するまでは通 常の画素と同等に動作する.そのため、自己リセットを起こす照度以下の条件で撮像 することにより、通常のイメージセンサで撮像したものと同等の画像を得ることがで きる.そのような条件下での撮像を"通常モード(normal mode)"とし、自己リセットを 生じる高い光強度下での撮像を"自己リセットモード(self-resetting mode)"と呼称する. 図 3-29 に通常モードにおける内因性信号の測定結果を、図 3-30 に自己リセットモ ードにおける内因性信号の測定結果をそれぞれ示す.なお、実験条件は上記の内因性 信号検出実験と同様であるが、ノイズ量の比較を行うため、試行平均ではなく単回の 刺激時の測定結果を示している.また、グラフはそれぞれグラフ右上に示した画像中 の赤点で示した画素の光強度変化を示している.





Intrinsic signal taken by the self-resetting mode

図 3-29 および図 3-30 のグラフでは、それぞれ刺激(0 [s])から 3-4 秒後をピーク としておおよそ 1%の光強度変化が観察されている.これは既報[43]ともおおよそ整 合し、ヘモグロビンの酸化還元に伴う内因性信号を測定できているといえる.ただし、 既報[43]にある刺激直後のマイナス方向の微弱な変化"Initial dip"は観察されていない. これは観察した領域の血管の直径が比較的小さなものが多く、ヘモグロビンの酸化還 元の反応に比べて血量の体積変化が小さかったため、"Initial dip"のような応答がみら れなかったと考える.

図 3-29 と図 3-30 を比較すると,図 3-29 の通常モードに比べ図 3-30 の自己リ セットモードでは明らかにノイズ比を低減できていることがわかる.刺激前の-15~-5 [s]の区間での偏差をノイズ量とし、刺激後 15 [s]までの 20 点ごとの移動平均のうち ベースラインからの変化量が最大となる点を信号量として信号対雑音比を算出する と、図 3-29 では 8.6 [dB],図 3-30 では 16 [dB]となった.自己リセットモードでは 一般的に信号の信頼区間の目安となる 3σ (9.5 [dB])を大きく超え、6σ 程度の信頼性を 確保することができている.これにより自己リセットモードでは、内因性信号の検出 に関しては変化量の閾値を設定するなどの簡便な検出法でリアルタイムに脳神経活 動を可視化できることが示された.

3.6 考察とまとめ

本章では低消費電力型自己リセットセンサを開発し,自己リセット画素の消費電力 を低減することで熱の発生を抑制し,熱起因のノイズを大きく減じられることを実証 した.また,開発したセンサを用いてマウス頭部に埋植可能な脳機能イメージングデ バイスを作成し,従来より高い信号対雑音比(SNR)での脳機能イメージングが可能で あることを示した.

本章で開発した自己リセットセンサは前章で開発したセンサに比べ 90%近い低消 費電力化に成功しており,実用領域の SNR でおおよそ 5 [dB]の改善が得られた.実効 的なピーク信号対雑音比は 64 [dB]が得られた.開発したセンサの画素サイズは 15 × 15 [µm²]と小型であり,脳神経活動の観察に十分な分解能を持つ.

また、このセンサと橙色 LED を組み合わせ、脳内に直接埋植可能な脳機能イメージングデバイスを製作し、制御システムや PC、電気刺激装置と組み合わせたイメージングシステムを構築してマウスの脳機能イメージングを試みた.測定の対象としたのは脳内の自然な生理現象に由来する微弱な内因性信号であり、蛍光標識の導入を伴う他の手法に比べ簡便な実験手順で信頼性の高い脳機能可視化技術を提供することができる.

撮像された脳表面の画像は自己リセットセンサ特有の光強度情報が圧縮された状態であったが,自己リセット回数の推定手法を提案し,実際に画像を処理することで, 通常のイメージセンサと同等の画像出力を復元可能であることを示した.一方で,出力の線形性や自己リセット機構の安定性に一部課題がみられた.センサの実用性を鑑みながら今後検討が必要である.自己リセットセンサの圧縮された画像出力情報の補 正については,本研究の発表後,事前キャリブレーションが不要な補正理論[73]やノ イズの低減が可能な補正理論[74]が提案されており,今後の適用による応用範囲の拡大が見込まれる.

自己リセット型 CMOS イメージセンサは内因性信号のような微弱信号を光学的に 観察する上で有利であり、今後脳内に限らず小型・高分解能・高信号対雑音比のイメ ージングが要求される多様な用途での活用が期待される.

第4章 埋植用フレキシブルデバイスプラットフォームの開発

4.1 はじめに

埋植型イメージングデバイスの次の課題としては、撮像視野の拡大が挙げられる. 埋植型イメージングデバイスは、原理的にはごく少数の神経細胞群または単一細胞の 神経活動を可視化できるほどの分解能を持つが、現状その撮像視野は単一の脳領域程 度(~1 [mm²])に留まっている.これが、同程度の分解能で複数の脳領域を同時に観察 することが可能となれば、他の脳機能イメージング手法には困難な脳内ダイナミクス の神経細胞レベルでの解明につながり、脳機能解明が飛躍的に進むと期待される.

ところが、埋植型イメージングデバイスはセンサ素子を被写体に直接接触させ、被 写体と画素を1対1で相対させるコンタクトイメージングによって撮像しているた め、観察視野がセンササイズに制限される. 広域の撮像にはより大きな素子サイズの センサを用いることが考えられるが、数 mm の曲率を持つマウスなど小動物の脳表面 に対して 1~2 [mm]以上の平面形状のセンサを埋植すると、センサと被写体である脳 表面間に容易に数百µm 規模の間隙が生じ、光の拡散によりイメージング時の分解能 が著しく低下する. また、生体侵襲性の観点からも硬い1枚板形状のセンサを埋植す るのは好ましくない.

これまでに先行研究[28]では六角形状の CMOS イメージングデバイスの複数埋植 や、単一のフレキシブル基板上に2個のイメージセンサを搭載した埋植デバイスを用 いて視野の拡大が試みられたが、デバイスサイズがマウスなど小動物に対して大きく、 埋植下での自由行動が困難であり、またデバイスが生体組織に対して硬すぎるため、 自由行動中に生体組織を傷つける恐れがあった.デバイスの屈曲性も十分とは言えず、 デバイスが脳の曲率に沿いにくいため分解能の低下も生じていた.

そこで、本章ではデバイス構造を根本的に見直し、生体侵襲性を抑えつつ視野の拡 張が容易な埋植用フレキシブルデバイスプラットフォームを提案する.また、従来の デバイス製作工程は多くが手作業に依存しており、デバイスの製作数に比例して製作 時間がかかり、生理学研究に必要な多数のデバイス需要を満たすには不適であった. 本章の製作プロセスでは、半導体素子の製作で一般的なバッチプロセスを重視するこ とで、多数のデバイスを同時かつ均質に製造可能なプロセスとすることにも留意した.

考案したプロセスの実用性を示すため、本章では実際に小型イメージセンサを搭載 した埋植デバイスを試作し、生体脳中での血流動態イメージングも試みた.さらに、 デモンストレーションとして試作したいくつかの複数素子搭載デバイスを示し、デバ イスの拡張性を明らかにする.

4.2 フレキシブルデバイスによる広範囲脳機能イメージング

生理学の分野では感覚や運動に関わる脳領域の局在が一般的に知られている[1]が, さらに近年では活動領域だけでなく,異なる領域と連携した脳機能が構成されている ことが発見されている[28],[75].たとえば、マウスのひげや目、その他の体の運動と それらの感覚情報は、脳表面の運動野および感覚野で処理されるが、それぞれが独立 して機能するのではなく、互いに密接に協調していることが指摘されている[76].と ころが、現状では十分な視野範囲を同時に高分解能で観察する脳機能イメージ手法が 欠落しているため、より詳細な体部位同士の結びつきの解明は困難となっている.ま た、脳内で外界情報や抽象概念を表す神経表象がどのようにして生成されるかは、複 数ニューロンによる神経回路を明らかにしなければ解明することができず[77]、脳内 の複雑な思考の構造を明らかにするためにも広視野・高分解能の脳機能イメージング 手法が必要となる.

現在,生理学で標準的に用いられている神経活動記録法は,脳組織中や脳表面に埋 植した電極により細胞外電位を測定する手法である.この手法は単一神経細胞や局所 的な神経細胞群の活動を記録することができ,時間分解能に優れている.しかし,同 時に多数の神経細胞を同定しながら測定することは,原理的に複数神経細胞が重畳し た信号を分離解析することが困難であることから,現状では十分に実現できていると は言えない[78].現在提案されている埋植型電極アレイの形態としては,剣山型電極 アレイの"ユタ電極[79]"や,極細の針に多数の電極を配置したデバイス[80],薄膜フィ ルム上に多数の電極を配置したフレキシブル電極アレイ[81]-[83]などが提案されて いる.特にフレキシブル電極アレイは高次機能の集中する脳表面の形状に沿って柔軟 に変形し,広い範囲で電極と組織が密着を保つため,脳表面を広域にわたって観察す るのに適している.生体に対する侵襲性も比較的抑えることができる.より空間分解 能に優れる光学的観察をこのようなフレキシブルアレイに適用することができれば, 侵襲性を抑えつつ,高次機能の集中する脳表面を,広範囲にわたって安定して十分な 時間・空間分解能で観察可能な脳機能イメージング手法が実現すると考えられる.

4.3 フレキシブルエレクトロニクスの応用

近年、フレキシブルな薄膜上に機能素子を形成し、屈曲させたり物体の表面に張り 付けるなどして用いることができる電子デバイスを製作する技術が急速に発達して おり、この分野はフレキシブルエレクトロニクスと呼ばれている。特にフレキシブル エレクトロニクスの発達は有機トランジスタ技術の発展に依るところが大きく、Rollto-Roll プロセスや常温常圧プロセスの適用などと相まって電子デバイスを安価に大 量生産できる技術として注目を集めている。一方で、有機トランジスタは単結晶 Si を ベースとした無機トランジスタに比べ特性の均一性や寿命に課題があり、また対応す る動作周波数が比較的遅いため、CMOS イメージセンサのような大規模かつ高速・高 信号対雑音比が求められるデバイスを作成するのに適していない。

そこで、本研究はフレキシブルデバイスで高速・高精度・高分解能の広範囲光学測 定を実現するために、単結晶 Si ベースの無機固体素子を小型化、分散して薄膜上に実 装する技術の開発を目指す.埋植デバイスを製作する上で、小型の無機固体素子をフ レキシブル基板上に実装する技術はこれまでにいくつか報告されている[84]、[85]が、 基板厚が比較的厚かったり(数百 µm~数 mm)、デバイス構造が光学測定に適してい なかったりし、直接の適用は難しい.また、無機固体素子を薄膜上に実装する技術も 報告されている[86]-[89]が、製作プロセスがあまりにも複雑で実用性を欠いたり、対 応する素子の構造に制限があったりするため、これらの直接的な応用も難しい.さら に、埋植型イメージングデバイスでは CMOS イメージセンサは一般的な LSI の試作 プロセスを利用して製作されるが、最表面の配線材料や電極パッドはほとんどが AI である.電極の AI は空気中で迅速に酸化され不導体の酸化膜を形成するため、電極 パッドとフレキシブル基板の配線を接続するためには、この酸化層を除去する工夫が 必要である.

本研究では、埋植デバイスに必要な生体適合性、防水性、絶縁性をクリアしつつ、 CMOS イメージセンサと測定対象となる脳組織間の間隙やフレキシブル性に影響す る基板の厚みが最小限となり、かつ一般的な LSI 素子や光学素子の組み込みを許容す る、生産性の高いプロセス技術の開発を目標とし、従来のフレキシブルエレクトロニ クスを部分的に応用しながら脳内埋植型イメージングデバイスに特化したプロセス の開発を行った.

4.4 デバイスプロセス

4.4.1 デバイスの構成材料

埋植可能なフレキシブルデバイスの被覆や基板となる材料には,柔軟性はもちろん, 電子素子と体液を安全に隔離するための防水性・絶縁性や,埋植部の炎症を招かない 生体適合性,無毒性が求められる.これらを満たし,埋植デバイスの材料として先行 研究の多いものとしては,Polydimethylsiloxane (PDMS)[90], [91]や Polyimide[92], [93], SU-8[94], Parylene-C[82], [83], [95], [96]が挙げられる[97].

PDMSは2液硬化性のシリコーンゴムであり,高い透明性と柔軟性,伸縮性を持ち, 米国食品医薬局薬局方のクラス IV の生体適合性物質として認可されている.しかし, PDMS は配線との接着性や薄膜の形成に課題があり,薄膜状のデバイスの材料には最 適とは言えない[8]. Polyimide は強靭で比較的耐熱性の高いポリマーであり,市販さ れている FPC 基板の基板材料である.生体適合性の高さも示されつつあるが,米国薬 局方には未認可の材料である.応力によるクラックが生じやすいことが報告されてお り[97],[98],吸湿性が高いことから生体中での絶縁性などの特性の変化が懸念される. SU-8 はエポキシ樹脂ベースのフォトレジストであり,フォトリソグラフィによる立 体構造の形成に適している.しかし,比較的柔軟性に乏しく,これも目的とするデバ イスの材料としては最適ではない.Parylene-CはChemical vapor deposition (CVD)に よるコンフォーマルフォーミングが可能なポリマーであり,薄膜では良好な光学的特 性と柔軟性を発揮し,絶縁性,防水性,伸縮性に優れている.米国食品医薬局薬局方 のクラス IV の生体適合性物質として認可されており,フォトリソグラフィに用いる 様々な薬品に耐性を持ち,µm オーダーの無欠陥の薄膜を形成可能など,薄膜デバイ スを製作する上でメリットが大きい[99].

以上の理由から、本研究では基板材料およびデバイスの被覆として Parylene-C を用いた. 埋植デバイスでは第2章, 第3章や先行研究[26]-[29], [100], [101]のように基板材料と被覆材料を分け、それぞれの欠点を補う方法もよく用いられるが、デバイス全体の厚みを最小化する上では、単一材料で全ての特性を満たせた方が好ましい.

また,配線材料としてはAuを選択した.Auは電気伝導性が高いため配線厚を薄くでき,展延性に優れるためフレキシブルデバイスの変形にも断線することなく追従することが期待される.金歯にも使われるなど生体毒性も低く,万一のデバイスの破損の際にも安全性が保たれる.そのほか,金属配線をParylene-C基板に密着させる目的でTiをバッファ層として成膜した上,Ptを成膜チャンバを移動する際の酸化防止膜として成膜している.TiやPtも生体毒性の小さい代表的な金属である.

4.4.2 プロセスチャート

開発したデバイスプロセスの概略図を図 4-1 に示す. プロセスの構築にあたって は、軟弱な薄膜に可能な限り応力が加わらないよう工夫したほか、生産性にも配慮し ている. 各工程の詳細は以下のとおりである.



図 **4-1** 薄膜を基板としたフレキシブルデバイスの製作プロセス Fabrication process for the flexible device based on the thin-film substrate

(a) スライドガラス上にレジストで素子配置パターンを形成する.スライドガラスは Micro slide glass S2215(Matsunami, 26×76×1.2 [mm³])の非フロスト加工面を使用し、使用前に Acetone 浸漬下での超音波洗浄 10 [min]および

IPA (2-propanol)でのリンス 3 [min], N₂ブローによる乾燥を行った. レジ ストはドライフィルムレジスト(RY-3315EE, Hitachi Chemical Co., Ltd.)を用 い, ハンドローラを用いて 60°Cに加温した状態でスライドガラスに貼付 した. また, 露光前に 110°Cで 5 [min]プリベークを行った. 露光にはマス クアライナ(MA-10, MIKASA)を用い, 露光条件は 9.0 [mW/cm²], 15 [s]とし た. レジストの現像は常温の 0.8% NaHCO₃ 水溶液に 55 [s]浸漬して行い, その後脱イオン水で 30 [s]のリンスを 2 回繰り返した. 最後に 90°Cで 5 [min]のポストベークを行った.

- (b) パターニングを行ったスライドガラス上に型枠を設置し、シリコーンゴム を流し込むことでシリコーンスタンプを作成した.型枠は 2 [mm]厚のア クリル板を CO₂ レーザ加工機(VLS2.30, Universal Laser Systems, Inc)により 加工して作成した.シリコーン充填前には各部材にシリコーン離型剤を塗 布した.シリコーンは KE-106 と CAT-RG(信越シリコーン)を 10:1 で混合 し、150℃で 30 [min]加熱することで硬化させた.また、シリコーンスタ ンプの背面を平面に保つため、硬化時に(a)と同条件で洗浄したスライド ガラスによって充填したシリコーン上面を圧迫した.
- (c) スライドガラスおよび型枠をシリコーンから分離し, エタノールで洗浄した.
- (d) シリコーンスタンプ上に CMOS イメージセンサチップや LED, FPC コネ クタといったデバイスを構成する素子を配置した. CMOS イメージセン サチップは事前にダイシング装置(A-WD-10B, ACCRETECH)で既定の寸 法に加工し, (a)のスライドガラスと同様の方法で洗浄したものを用いた.
- (e) 仮固定板を用意する. 仮固定板(PROLEADER, 富士フィルム)には後に犠 性層となる粘着性 PVA (Polyvinyl alcohol)シート(アイセロ)を貼付してお
 く. PVA シートには台紙として PET (Polyethylene terephthalate)フィルムが
 貼りつけられており, PET フィルム側を直接仮固定板に貼付した.
- (f) 素子を配置したシリコーンスタンプを,仮固定板上の粘着 PVA 層に圧着 した. 圧着時の圧力は任意であるが,圧力が過小であると素子が PVA に 十分密着せず,過大であると PVA 層の変形を招き,それぞれ転写不良の 原因となる.
- (g) シリコーンスタンプを粘着 PVA から引きはがした.このとき,粘着 PVA と素子間の粘着力がシリコーンスタンプと素子間の粘着力に勝り,かつ粘着 PVA とシリコーン間にはほとんど粘着力が生じないため,安定した素子転写が可能となる.
- (h) 基板全面に Parylene-C をパリレンコータ (PDS2010, Specialty Coating Systems)で CVD 蒸着した. 目標膜厚は 2.5 [µm]とし, 成膜時のチャンバ内 圧力は 35 [mTorr]とした. Parylene-C はコンフォーマルフォーミングが可 能で, 複数の素子が載った複雑な形状の基板にも均一な厚さの薄膜を形成

することができる.

- (i) 素子の載った基板面上で固形ワックス(マグトロンワックス,日化精工)を 80℃に熱して溶解し、基板全面に塗布したうえで支持基板(窒化アルミニ ウムセラミックス、26×76×2 [mm³])を接着した.
- (j) 徐冷しワックスを硬化後,常温の脱イオン水に浸漬して粘着 PVA 層を溶解した.仮固定板の剥離が溶解作用によって行われるため,素子や Parylene-C 薄膜にほとんどダメージを与えることなく作業を進めることができる.剥離後は常温の脱イオン水で数度のリンス洗浄を繰り返した.
- (k) 表面アッシングを行い残留 PVA の除去および Parylene-C 表面の活性化を 行った.アッシングはアッシング装置(FA-1, samco)を用いた酸素プラズマ エッチングで、チャンバ内圧力 10 [Pa]、酸素流量 10 [ml/min]、プラズマ 電力 50 [W]として 30 [s]行った.
- (l) 2 層目の Parylene-C 成膜を行った.目標膜厚は1 [μm]とした.その他の条件は(h)と同条件である.この層は1 層目と素子間の間隙を緩和する目的で成膜する.
- (m) レジストでパターニングを行う. レジストには(a)で用いたドライフィルムレジストを用いた.素子の載った基板面は理想的には平面だが,実際は微細な凹凸やうねりが生じている.このような面に一般的なスピンコーティングによる液体レジストの均一塗布を行うのは困難であり,パターニングの不良を招くため,比較的曲面上にも対応しやすいドライフィルムレジストを用いた.また,基板固定に用いている固形ワックスの融点は65℃程度であるため,(a)と同様の条件でのフィルム貼付は困難である.したがって,この工程ではフィルムは45℃の加熱下でハンドローラを用いて貼付した.露光や現像,リンス条件は(a)と同様とした.プリベーク及びポストベークはそれぞれ45℃,5[min]とした.
- (n) 蒸着工程で製膜する金属膜と素子電極の導通をとるため,素子電極パッド 上の Parylene-C 膜を Nd:YAG レーザ(λ = 266 [nm], Callisto VL-C30, V-Technology)でエッチングした. エッチング後は(k)と同条件でアッシング を行い,素子上の残留した Parylene-C やパーティクルを除去した.
- (o) 真空スパッタ装置(CFS-4ES-II, SHiBAURA)内で逆スパッタ(エッチング), Ti スパッタ, Pt スパッタを連続して行った. 逆スパッタは CMOS イメージセンサ電極パッド上の酸化膜を除去する目的で行い, Ti は金属膜と薄 膜基板等の密着性を向上させる目的で成膜した. Pt は後の工程で Au の蒸 着を行うが,その際成膜チャンバを移動し,一度真空を破る必要があるため, Ti 表面の酸化を防ぐために成膜した. Au を同装置でスパッタリング により成膜できれば Pt 層は不要である. 逆スパッタはチャンバ内圧力 1.0 [Pa], Ar 流量 10 [sccm], プラズマ電力交流 50 [W]として 1 [min]行い, Ti スパッタはチャンバ内圧力 0.6 Pa, Ar 流量 20 [sccm], プラズマ電力直流

100 [W]として1 [min], Pt スパッタはチャンバ内圧力 0.6 [Pa], Ar 流量 20 [sccm], プラズマ電力交流 200 [W]として 30 [s]行った. Ti および Pt の目 標膜厚はそれぞれ 20 [nm], 30 [nm]である.

- (p) 続いて,真空蒸着装置(VPC-260F,ULVAC KIKO Inc.)を用いて Au を抵抗加 熱蒸着した.チャンバ内圧力は 7×10⁴ [Pa]程度とし,~1 [nm/s]程度の成膜 速度で 400 [nm]成膜した.このとき,基板裏面には冷却を目的として真鍮 ブロックを真空グリスを用いて張り付けた.また,成膜時に基板の過熱に よりワックスが溶解することを防ぐため,成膜は 200 [nm]ずつ 2 回に分 け,1 [hr]程度のインターバルを置いた.成膜完了後,真鍮ブロックを基板 から取り外し,真空グリスをエタノールで洗浄した.
- (q) 基板を常温の有機アルカリ(NMD-3, 東京応化工業)に 20 [min]浸漬し, フィルムレジストを溶解剥離した.この工程により素子を搭載した基板面の 全面に成膜した金属膜をリフトオフし, 金属配線パターンを形成する.ま た,フィルムレジストのリフトオフは通常 2% NaOH 水溶液を用いて行わ れるが, NaOH 水溶液は CMOS イメージセンサの電極パッド(Al)を著しく 損壊するため,代替法として有機アルカリを用いている.リフトオフ後は 脱イオン水で1[min]×2回洗浄した.また,Parylene-Cの表面を活性化す るため,(k)と同条件でアッシングを行った.
- (r) 3 層目の Parylene-C (2.5 [µm]厚)を蒸着した.この層は後工程のデバイスリ リース時に金属配線パターンを保護する目的で成膜する.成膜条件は(h) と同様である.
- (s) デバイス外形形状を(n)と同様に Nd: YAG レーザでエッチングした.
- (t) 基板を 80℃のワックスリムーバ(ニッカゾール,日化精工)に浸漬し,ワックスを除去した.ワックス除去後,同条件のワックスリムーバおよび常温の IPA でそれぞれ 3 [min]リンス洗浄した.
- (u) デバイスのリリース後、フレキシブルコネクタ部にカプトンテープを貼付し、カプトンテープ部を支持部として Parylene-C 成膜装置内に吊るした.この状態で5[µm]厚の Parylene-C を成膜した.このようにすることで、フレキシブルコネクタ部以外のデバイス全面に均一な Parylene-C 膜を成膜することができ、フレキシブルコネクタ部以外からの素子部への浸水の危険性が減少する.フレキシブルコネクタ部は埋植時体外に設置され、通常濡れることは少ないので、実質的にデバイスは十分な防水性を備える.成 膜条件は(h)と同様である.
- (v) フレキシブルコネクタの PCB 基板接続部の Parylene-C をピンセットなど で除去し,電極を露出させる.以上でフレキシブル埋植デバイスの完成で あり,実験動物の脳内などに埋植して用いる.フレキシブルコネクタは共 通規格により市販のコネクタを通して PCB 基板に簡単に脱着することが でき,埋植部のみをディスポーザブルとして測定装置の流用が可能である.
4.4.3 プロセスの構築について

本プロセスの主要な改善点は、複数素子を一つの回路としてまとめるパッケージン グに、平面フォトリソグラフィ技術を直接適用したことである.一般的に平面フォト リソグラフィ技術は Si 基板などの極めて平面度が高い面に素子構造を形成する技術 であり、集積回路など密で微細な構造の形成に適している.古典的な研磨・切削・描 画といった手法が構造の複雑さに比例した加工時間を要求するのに対し、フォトリソ グラフィ法のようなバッチプロセスは構造の複雑さと加工時間が直接の比例関係に なく、大量のパターン構造を一斉に作り込むことができ、デバイスの大量生産に適し ている.一方で、素子のパッケージングは一般的にはワイヤボンディング法やハンダ などのより古典的に近い加工法が用いられており、大量の素子を効率よく実装してい くのにあまり適していない.バッチ処理では不良の発生が領域ごとなどの傾向として 現れるが、古典的手法では傾向に関係なく不良が発生しうるため、デバイスの信頼性 を向上させていく上でも、デバイスの製作にバッチ処理であるフォトリソグラフィ法 を適用するのが望ましい.

これまでデバイスのパッケージングにあまりフォトリソグラフィ法が適用されな かった理由としては、フォトリソグラフィ法が液状感光材料のスピンコーティングに よる均一な塗膜やコントラスト比の高い光照射パターンを要求するため、素子と基板 が凹凸形状を成すような不均一な表面に実用的な配線パターンを形成することが困 難であったことが挙げられる.凹凸形状にも対応した 3 次元フォトリソグラフィ法 [102],[103]も提案されているが、スプレーコーティング装置など従来の平面フォトリ ソグラフィから設備の更新が必要となり、即時の適用は難しい.また、複数素子を樹 脂に包埋し、素子表面と樹脂の均一面を形成した上で平面フォトリソグラフィ法によ り素子間の配線を形成する Fan-out wafer level packaging (FOWLP)技術[104]も提案され ているが、主にコンピューティング素子の実装密度を向上させるために開発されてお り、樹脂によってデバイス全体が硬い構造となるため、フレキシブルデバイスへの直 接の適用は難しい.

そこで、本研究ではあらかじめ素子間に柔軟な薄膜による基板を形成した上で、 FOWLP で用いられている樹脂包埋による均一な平面の形成を一時的に行い、平面フ ォトリソグラフィ法による配線形成などを行った後に樹脂を全て溶解除去するとい うプロセスをとっている.これにより、素子以外の基板や配線といった構造がフレキ シブルとなり、デバイス全体では埋植に十分なフレキシブル性を確保できると期待さ れる.包埋する樹脂がない分、デバイス全体の厚みの低減も期待できる.FOWLP で 用いられる技術をフレキシブルデバイスの開発に容易に転用することも可能と考え られる.今回プロセスを構築する上では、素子のアライメントは PDMS スタンプ法 [84],[87],[91]を参考に、配線や基板の形成は Parylene-C 薄膜を基板とした埋植用の Electrocorticography (ECoG)デバイス[82]を参考とした.また,FOWLP などとは異なり、 脆弱な薄膜を基板として用いるため、加工表面への応力の集中は極力避けなければな らなかった.そこで、プロセス中に用いる一時的なサポート基板などは溶解作用によ って剥離できるよう工夫した.

ところが、実際のプロセス上では、素子表面と薄膜基板表面間に無視できないレベルの段差が生じ、配線を形成する上での大きな課題となった.配線はスパッタや蒸着によって基板に垂直方向に成膜されるため、素子表面と薄膜基板表面間のミスマッチにより素子側壁の垂直面が露出すると、その部分で断線が生じる危険性が高い.この段差の発生は工程(f)の素子転写の際に圧力を過大にかけてしまうことが原因となっており、転写圧力を最適化することで抑制できると考えられるが、本研究では手作業により転写を行っていたため、転写圧力の制御が困難であった.そこで、本研究では類似したコンセプトを持つデバイス[88],[89]のプロセスを参考とし、素子および基板表面に直接配線を形成するのではなく、表面形状を平滑化する目的でParylene-Cのバッファ層を取り入れた(工程(I)).Parylene-CはCVDによるコンフォーマルコーティングで成膜されるため、膜厚と同程度の間隙や直角形状などの急激な形状の変化を緩和し、より連続的な表面を形成することができる.これにより工程(I)および工程(n)が追加され、デバイス全体の厚みが増してしまうが、プロセス全体の歩留まりが大きく向上し、はじめて埋植実験が可能なデバイスの試作に繋がった.

また、プロセスを構築する上では多様な材料のプロセス耐性が課題であった.例え ば、工程(i)で用いる仮固定用のワックスには有機溶剤やアルカリなどに対する耐薬品 性の高いものを選定した.理想的にはワックスは常に耐薬品性の高い Parylene-C に保 護されるため、ワックスには耐薬品性が不要なはずであるが、実際はサンプルを取り 扱う上でデバイス部以外の領域に Parylene-C の破れが生じ、ワックスに耐薬品性がな い場合はワックスが侵食され歩留まりの低下につながっていた.リフトオフ工程(q)で 用いるアルカリ溶液も、レジストの仕様書上では 2 [wt%] NaOH 水溶液が指定されて いるが、NaOH 水溶液は素子の Al 電極を溶解し不適当であるため、より Al に対する 侵食性が弱い有機アルカリを用いた.

プロセス中の温度も問題となった. 例えば, ワックスは 65℃程度で溶解し, Parylene-Cは 100℃程度で変質することが報告[105]されている. プロセス中にはスパッタや蒸 着, アッシングなどサンプルの表面温度が上昇しやすい工程が含まれており, これら のプロセス中にサンプル温度が 65℃を超えないよう工夫する必要があった. 具体的 にはプロセス中に冷却期間を挟んだり, サンプルの支持基板に熱伝導率の高いセラミ ック板を用いたり, サンプル裏面に熱伝導率が高く比較的熱容量の大きい金属ブロッ クを貼り付けるなどして対策を行った.

さらに、プロセスの簡略化も課題であった.当初はプロセスのほとんどすべての工 程をバッチ処理とするため、Parylene-C 膜のエッチング工程(n)、(s)はフォトリソグラ フィ法によって実現していた.ところが、フォトリソグラフィ法による Parylene-C 膜 のパターニングは、Al 膜の蒸着・レジストの塗布・露光・現像・Al のウェットエッチ ング・レジストの洗浄・Parylene-C のプラズマエッチング・Al 膜のウェットエッチン グという比較的長いプロセスを経なければならず、デバイス試作に必要な期間の長期 化を招いていた.このようなバッチ処理によるプロセスは、大量生産を行う際には有 利に働くが、少量を試作する際には必ずしもプロセス期間の短縮には繋がらない.そ こで、本研究ではNd:YAG レーザのビームを用いて Parylene-C を蒸散させることでエ ッチング工程を代替した.ビームをパターン形状に走査させることでフォトリソグラ フィ法と同様にパターニングできるが、走査距離に比例してプロセスに時間が必要と なる.しかし、それを考慮してもプロセス全体では大幅な期間の短縮に繋がった.

デバイス全体の厚みに関して、最も影響が大きいのはセンサや LED といった素子 自身の厚みである. デバイス全体の厚みを低減することができれば、後述するような 生体組織間にデバイスを挿入するような用途において応用範囲が広がり、生体侵襲性 の低減にも繋がる. そこで, センサや LED を薄型化する方策が求められる. まず, セ ンサなどの Si 素子に関しては,素子裏面の Si 層を薄くすることができる. 例えば CMOS の LSI 素子では Si 層を 1 [µm]程度まで削り込んだ例が報告されている[106]. CMOS イメージセンサの場合は受光部のウェルの深さが可視光の侵入長程度以上は 必要であり、またウェルで生じた光電子が素子裏面の格子欠陥にトラップされると画 像品質の劣化に繋がることを考慮すると、安全を見て 30 [μm]程度までなら Si 層を特 性の劣化なく削減することができると考えられる. Si 層を薄型化する方法としては、 50 [µm]程度までは機械的な研磨によっても可能であるが,それ以下では素子が脆弱と なりすぎるため、素子に応力のかかりにくい化学的エッチングによる薄型化が適する. また、薄型化した脆弱な素子の搬送には PDMS スタンプ法が適することが示されて いる[84], [87], [91]. LED の薄型化には, 青色や緑色 LED など GaN 層を含む LED に 限られるが、Laser lift-off (LLO)プロセスによる支持基板の剥離[84]が適する.LLO に より市販の LED をデバイス層のみとすることが可能であり、8 [µm]厚程度の LED を 得られる[107]. 本研究のプロセスは素子の厚みの差を吸収し, PDMS スタンプ法に基 づいた素子への応力を最小化できる工程となっているため、今後これら薄型化した素 子を用いてデバイス全体が薄く柔軟なデバイスを製作することも可能であると期待 される.

4.5 フレキシブルイメージングデバイスの試作と埋植実験

4.5.1 フレキシブルイメージングデバイス

図 4-2 に第4章4節のプロセスに基づいて試作したフレキシブルイメージングデ バイスを示す.本デバイスは1個の超小型 CMOS イメージセンサと FPC コネクタを 搭載する. Parylene-C 薄膜基板が11 [µm]厚,金属配線が400 [nm]厚, CMOS センサが 125 [µm]厚である.図 4-2 (a)に示すように、デバイスは直径1.5 [mm]のガラス管に 無理なく巻き付く程の良好なフレキシブル性を示した.図4-2 (b)から良好なアライ メント精度で製作できていることがわかる.設計上のアライメント余裕は各層15 [µm]である.また、図4-2(c)の SEM 画像から分かるように、イメージングデバイス の撮像面側はほとんど凹凸のないフラットな形状であり、埋植時に接触する脳組織を 傷つける恐れが低い.デバイス裏面(d)は素子が突き出したような形状になっているも のの、こちらの面はデバイスの脳表面への埋植時には比較的頑丈な硬膜や頭骨が来る ため、侵襲性を大きく損なうことはない.



図 4-2 試作したフレキシブルイメージングデバイス (a)デバイス全体写真 (b)センサ部拡 大写真 (c)デバイス表面 SEM 写真 (d) デバイス裏面 SEM 写真 Fabricated flexible CMOS imaging device (a) Entire image of the device (b) Microscopic

image of the sensor part (c) SEM image of frontside (d) SEM image of backside

表4-1に搭載した超小型 CMOS イメージセンサの仕様を示す.本センサは ams 社 の 0.35 μm CMOS opto process を利用して製作された, 0.5 × 0.9 [mm²]の超小型サイズ のイメージセンサである.フレキシブルイメージングデバイスでは,多数のセンサチ ップによる広視野イメージングを実現する際,少数の大面積チップをアレイ化するよ りも多数の小面積チップをアレイ化したほうがフレキシビリティの観点から有利で あるため,このような超小型チップを専用設計した.画素数は 44×52 である.また, 本デバイスのような配線厚が比較的薄いフレキシブルデバイスは,配線抵抗が高くな りがちであるため,電力消費・電力変動の大きい素子では素子における電圧変動が著 しくなる.そのため,イメージセンサなどを駆動するには不向きなことが多い.そこ で,本センサでは素子の小型化による消費電力低減と比較的ロバスト性の高いレギュ レータを内部に搭載することにより対策を行った.実際には内部レギュレータは不具 合により無効化して用いたが,比較的低い消費電力と,配線側の蒸着膜にしては比較 的厚い膜厚により,センサ動作に顕著な影響は生じなかった.薄膜配線の配線抵抗は 各ラインおおよそ 30 [Ω]であった.

表 4-1 超小型 CMOS イメージセンサの仕様

Technology	AMS 0.35 μm CMOS opto process
Supply voltage	2.4 V
Chip size	$0.5 \text{ mm}^{\text{H}} \times 0.9 \text{ mm}^{\text{V}}$
Pixel type	3-transistor active pixel sensor
Pixel size	$7.5 \ \mu m^{H} \ imes \ 7.5 \ \mu m^{V}$
Fill factor	43.8 %
Pixel number	44 × 52
Average power consumption	0.96 mW @ 328 fps

Specification of the ultra-small CMOS image sensor

また、基板配線と素子電極の接合部および接合部の I-V 特性を図 4-3 に示す. 図 4 -3 より、接合部はほとんど凹凸がない形状を実現できていることがわかる. また、 I-V 特性より、AI 電極表面の酸化層を除去するプロセスを採用したことによりオーミ ックな接合を実現できていることがわかる. なお、接合抵抗は~ $1.1 \times 10^4 [\Omega \cdot \mu m^2]$ であった.



図 4-3 基板配線と素子電極の接合部顕微鏡像および接合部の I-V 特性 Microscopic image of the bonding junction between the sensor pad and the wiring, and I-V characteristics of the bonding junction

4.5.2 実験動物の準備とフレキシブルイメージングデバイスの埋植

本実験は試作したフレキシブルイメージングデバイスによる脳表血流動態の可視 化を実証する目的で行った.脳表面の血流速は第3章2節で概観したように,血管周 囲の神経活動によって影響を受けている.したがって,脳表面の血流速は内因性信号 の一種であり,これを測定することで間接的に神経活動を観察することができる[70], [72],[108],[109].また,血流速の計測は脳梗塞や心拍の影響を直接観察する目的にも 適している.

本研究の動物実験は奈良先端科学技術大学院大学の動物実験等の実施に関する規 定に準拠して行った.実験には野生種の slc SD ラット(7 周齢,オス,230 [g],日本 SLC)を用いた.また、ラットは実験開始前に 10%ウレタン麻酔(カルバミン酸メチル を生理食塩水で希釈)の腹腔投与(1.0 [g/kg])により麻酔した.まず、ラット頭部をス テレオタキシック装置(SR-5M, Narishige)に固定し、次に頭皮および頭骨の一部を除去 して脳表の適当な箇所を露出させた.さらに、脳表を覆う硬膜の一部を切除し、フレ キシブルイメージングデバイスのセンサ部を硬膜の開口部から硬膜下に挿入した.図 4-4 にデバイスの埋植の様子を示す.フレキシブルイメージングデバイスが十分に 薄く柔軟であるため、脆弱な硬膜や脳表面を傷つけることなく埋植が可能であった. また、硬膜の張力によりデバイスと脳表面が自然に密着し、安定した測定が可能とな った.



図 4-4 デバイス埋植の様子(左)とセンサ部の拡大写真(右) (Left) Device implantation (Right) Microscopic image of the sensor part

図 4-5 にフレキシブルイメージングデバイスを用いた脳表面血流動態の測定系を示 す. イメージセンサは第4章と同様に中継基板および制御基板に接続され, PC によ りデータの記録を行った. また, 脳表面血流動態の可視化のため, デバイス埋植部に 向けて外部から中央波長 470 [nm]の青色 LED 光(LEDGFP-3W, Optocode Corp.)を照射 した.



図 4-5 フレキシブルイメージングデバイスを用いた埋植実験 Experimental setup for the implantation using the flexible imaging device

4.5.3 脳表面血流動態の観察

イメージセンサを 90.6 [fps]で動作させ, 脳表面を撮像した. 撮像例を図 4-6 に示 す. 図 4-6 の中央付近の画面上方から下方にかけて見える黒い太線が脳表面に走行 する血管である. 画面左端付近にはモザイク状の黒点や垂直方向の縞模様などが見え るが, これはデバイス製作時に Nd:YAG レーザの誤照射により画素にダメージが加わ ったためである. 同様のダメージは画面の四方 2~3 画素にもみられる. 画素ダメージ が顕著な領域は今回の解析範囲からは除外した.

血管中の血流速を測定するため,先行研究[28]と同様に血管のラインスキャンを試みた.まず,図4-7に示すように,血管の血流方向に沿って線状のRegion of interest (ROI)を決定する.血流方向の推定には撮像した動画のフレーム間差分動画が参考となる.次に,ROI上にある画素の画素値を抜き出していき,点Aから点Bに向かって縦一直線に並べていく.この操作を連続する 80 [frame]にわたって行い,各フレームの結果を左から順に並べていくと,図4-8に示すようなラインスキャン画像が生成される.このとき,血液を青色光で観察すると赤血球をはじめとする血中物質の吸光度差によって血管内にコントラスト差が生じるため,もし ROI に沿って血流があれば,ラインスキャン画像には黒点や明点が時々刻々と移動して形成する縞状の模様が現れるはずである.このとき,縞模様の角度をθとすると,血流速v [µm/s]は以下の式で表せる.

$$v = F \cdot \Delta P \cdot tan \theta \qquad \cdots 4-1$$



ただしFはフレームレート[fps], ΔP は画素ピッチ[μm].

Image example of the rat brain surface taken by flexible imaging device



図 4-7 ROI (赤線 A-B) Region of interest (ROI) (Red line A-B)



80 Frames

図 4-8 ROI のラインスキャン画像 Line scan image of the ROI

ところが、実際のラインスキャン画像は画素ごとに出力特性がばらついているため、 図 4-8 に示すように明瞭な縞模様は現れない.また、縞模様が現れたとして、瞬間 的な血流速だけでなく継続的な血流速変化を観察したい場合、先行研究[28]のように 画像を逐一人力で計測しプロットしていくのは現実的ではない.そこで、本研究では 次のような画像処理プログラム(MATLAB)を作成し、血流速計測の自動化を試みた.

画像処理の結果を図 4-9 に示す.まず,画素ごとの特性ばらつきはラインスキャン画像の各行内では同一であり,同一血管中で生じる血流による光強度の変化はある程度の時間をとれば同程度であるとみなせるから,図4-9(a)のようにラインスキャン画像の各行を規格化することで特性ばらつきを低減した.実際,図4-9(a)から処理後のラインスキャン画像は処理前に比べ血流による縞模様がより明瞭となってい

る.次に、画像を単純化してより縞模様の角度を検出しやすくするため、図4-9(b) 画像の2値化、図4-9(c)微小領域の削除、図4-9(d)エッジ検出、図4-9(e)ハフ変 換アルゴリズムによるエッジ角の測定を順次行った.実際の血流は血中物質が血管内 で3次元的に動くためコントラストが一定ではなく、血流速は時々刻々と変化し、ま たラインスキャン画像は多くのノイズも含むため、縞模様を一直線と仮定しての推定 は難しい.そこで、図4-9(e)に示すように、ハフ変換アルゴリズムによって画像内 から全長の長い直線 300 本を検出し、検出された角度ごとに直線の長さを積算して、 最も総延長の長かった角度をそのラインスキャン画像における代表角とした.実際に 図4-9(e)から得られた角度ごとの直線長を図4-10に示す.この場合、代表角は38° であり、式(4-1)より血流速は5.3×10² [μm/s]となった.ただし、ハフ変換アルゴ リズムによる角度検出の分解能は2°ごととし、総延長が最長の角度の決定は偶然によ る誤検出が起きやすいため、3点ごとの移動平均を適用したうえで最長の角度を決定 した(図4-10).以上より決定した代表角0をラインスキャン画像に重ねると、図4 -9(f)のようになる.



Estimation of the blood flow speed by image processing of the line scan image



図 **4-10** ハフ変換アルゴリズムにより得られた角度ごとの直線長 Total length of each degree calculated from Hough algorithm

以上の処理を各フレームごとに 110 秒分(およそ 10,000 [frame])のデータについて 適用することで、血流速度の時間変化を図 4-11 の通りグラフ化した. このグラフか ら、観察した血管の血流速は 4.5±1.5 [×10²µm/s]と推定された. これは赤血球追跡に よって測定された他研究[23]の血流速や先行研究[28]の結果と比較しても同等の値で ある.



また、測定結果が解析上の偶然性によるものではないことを示すために、血管外の 領域を ROI として同様の解析を行った.血管外では一定した血流がないため、理想的 には血流速は0となるはずである.図4-12に解析に用いた ROI を示す.図4-12に 示すように、この ROI には血管を示す比較的暗い領域は含まれていない.図4-13に 血流速の時間変化の解析結果を示す.解析の結果、血流速は-0.09±3.8[×10³µm/s]と 推定された.本解析法では明確な信号がない場合微弱なノイズが増幅して結果に反映 されるため、前述の結果に比べ誤差が20倍以上と大きな値となっている.また、血 流速の平均値も前述の結果に比べ1/4以下となっており、誤差の大きさに比べ有意な 値を示していない.このことから、本解析法による血流速の推定は確からしいことが 示された.ただし、血流速の信頼性を検証するためには、今後ドップラー計測法[23] など他手法を併用しての比較検討が必要である.



図 4-12 血管外に注目した ROI ROI for out of the blood vessels



Estimated blood flow speed for the out of the blood vessels

さらに、図4-14に示すように、本デバイスは頭骨に覆われた硬膜下にも挿入する ことができた.これはデバイス埋植時に頭骨の開頭領域を最小限に抑えつつ、開口部 から目的の箇所にデバイスをスライドさせることで、脳表面の多様な箇所に広くデバ イスを展開できる埋植法の確立につながる.ただし、今回の実験では手技が熟達して おらず、出血が生じ、スムーズな挿入にはデバイスが柔軟すぎたりセンサ部の突起が 障害になったりなどの問題も見られたため、それぞれの改善が必要である.



図 **4-14** デバイスの頭骨に覆われた硬膜下への埋植 Device implantation under the dura which is covered by the skull

4.5.4 フレキシブルイメージングデバイスの埋植実験:考察とまとめ

本節では柔軟な有機薄膜を基板としたデバイス製作プロセスを基に、フレキシブル イメージングデバイスを製作し、生体ラット脳に埋植することで脳血流の計測を実証 した.製作したデバイスは薄く平坦な構造で高いフレキシビリティを発揮し、ラット の硬膜や脳組織など軟弱な組織間に組織を傷つけることなく埋植可能であった.本デ バイスの基板材料として用いた Parylene-C のヤング率は 2-4 [GPa] [99]であり、従来基 板材料のポリイミド~8 [GPa] [110]と大差はない.しかし、曲げ剛性は長方形断面の場 合厚みの3乗に比例するため、従来の基板厚数十~数百 µm から 11 [µm]まで基板厚を 低減したことにより、従来より大幅に柔軟性が向上したと考えられる.また、埋植し たデバイスにより脳表血流のイメージングを試み、脳表面の撮像や、ラインスキャン 解析を行うことで血流の時間応答を観察可能であることを示した.一般的に配線厚の 薄いフレキシブルデバイスは配線抵抗が高くなりがちであり、消費電力の高いイメー ジセンサなどを動作させるには不向きであるが、蒸着膜にしては厚い配線厚やセンサ の消費電力低減などの効果により安定したセンサ動作を実現した.

4.6 デバイスの発展性について

提案したフレキシブルデバイス製作プロセスを応用して、図4-15 および図4-16 のようなデバイスも製作することができた.ただしこれらのデバイスは第4章4節の デバイスプロセス(I)-(r)を繰り返した2層配線構成となっており、基板厚は13 [µm]と なっている.図4-15はLEDを複数アレイ状に配置した(50 [dpi]相当)デバイスで あり、任意のLEDを個別に点灯することができる.このようなデバイスは脳表面へ の埋植により、オプトジェネティクスの光刺激装置として用いたり、埋植イメージン グデバイスの照明として用いたりする応用が可能である.図4-16は2色(青,緑) のLEDを搭載したフレキシブルイメージングデバイスである.このようなデバイス は、例えば適したチャネルロドプシンと組み合わせることにより、1色は神経細胞の 光刺激用として、もう1色は脳機能イメージング用として用いる、双方向の神経イン ターフェースとして使うことができる.また、あるいは2色で異なる脳内現象を観察 するマルチモーダルイメージングシステムとして使うことができると想定している.

このように、提案したフレキシブルデバイス製作プロセスは素子の複数化や配線の 多層化に対応しており、より大面積かつ複雑な埋植デバイスの製作にも適していると 考えられる.さらに、Au 配線上の Parylene-C を一部除去し電気生理用の電極として 用いたり[82]、Parylene-C でトンネル状の構造を作成しマイクロ流路や仮補強材の容 器として用いたり[96]、あるいはフレキシブル基板上に無線送電アンテナや受電素子 を設けて完全体内埋め込み型のデバイスとしたり[85]など、既存技術との組み合わせ により考え得る応用の幅は広く、有機トランジスタをベースとしたフレキシブルデバ イスよりも高性能な埋植デバイスを開発できる見込みは大きい.

一方で、本研究は各層の厚みや材料、製造条件を最適化するには至っておらず、特 に生体内での長期埋植性をはじめとした今後の調査・研究が必要である.また、脳機 能イメージングデバイスはイメージセンサや LED といった光学素子を多数搭載する ため、それぞれの光学的影響を考慮しなければならない.例えば、デバイス裏面に Al を蒸着するなどして素子間を遮光分離するなどの措置が考えられる.さらに、筋肉や 心臓表面など変形量の大きい組織に埋植する際には、デバイスにはフレキシビリティ だけでなくストレッチャビリティ(伸縮性)も求められる.これには、デバイス基板 膜に多数の貫通穴を開けメッシュ状の基板にするなどの対応が考えられるが、 Parylene-C は比較的伸縮性の高い材料であり、配線材料の工夫によっては大幅な構造 の変更を必要とせず伸縮性を付与できる可能性がある.



図 4-15 フレキシブル LED アレイ (a) LED アレイ拡大写真 (b) 全体図 (c)点灯例 Flexible LED array (a) Microscopic image (b) Entire device (c) Illumination example



図 4-16 マルチカラー照明付きフレキシブルイメージングデバイス (a)裏面拡大写真 (b)表面拡大写真 (c)全体写真 (d)点灯例

Flexible imaging device with multi-color LED (a) Microscopic image of the backside (b) Microscopic image of the frontside (c) Entire device image (d) Illumination example

4.7 まとめ

本章では、既存の電気生理用フレキシブルデバイス[82]やフレキシブルエレクトロ ニクスの概念を融合し、無機固体素子ベースの埋植可能なフレキシブルデバイスおよ びその製作プロセスを提案・実証した.提案したデバイス構造はイメージセンサなど の光学素子の搭載に適しており、生体内に埋植可能な防水性、絶縁性、生体適合性を 備えた、薄膜状のフレキシブル構造である.製作プロセスはほとんどがバッチプロセ スに対応しており、量産応用も期待できる.

また,試作したフレキシブルイメージングデバイスは良好なフレキシビリティを発 揮し, ラットの硬膜や脳組織など軟弱な組織間に組織を傷つけることなく埋植可能で あった.脳内では安定したイメージングが可能であり,脳表面の撮像や,撮像した画 像からの血流速解析を実証することができた.

さらに、個別点灯可能な多数の LED を搭載したフレキシブルデバイスや、2 色の LED を搭載したフレキシブルイメージングデバイスを試作し、提案した構造およびプ ロセスの発展性を示した.実証した応用以外にも考え得る発展の余地は大きく、今後 の開発が期待される.なお、本研究はフレキシブルデバイスの製作プロセスを提案・ 実証するに留まっており、デバイスの電気的・機械的特性や環境耐性の最適化には至 っていない.今後各要素の影響調査と最適化が必要である.

第5章 結論

5.1 本研究の成果

本研究では、生体埋植型 CMOS イメージングデバイスの実用化に向け、CMOS イ メージセンサのダイナミックレンジおよび信号対雑音比向上による応用範囲の拡大 と、フレキシブルな有機薄膜上への半導体素子実装技術の開発によるデバイス侵襲性 の低減について、基礎的な検討を行った.本研究によって以下の成果を得た.

▶ 自己リセット型 CMOS イメージセンサによる明環境下蛍光イメージング

通常のイメージセンサはある一定以上の光が入射すると光電変換により生じた電荷が画素内のキャパシティを超過し出力が飽和するという現象を起こし,測定可能な光強度に限界が存在する.本研究では,画素の動作を工夫することで,高い光強度下でも画素の飽和を回避し,かつ幅広いダイナミックレンジで一定感度を保つという特性を示す自己リセット型イメージセンサを開発することに成功した.また,本センサを用いることで,通常は暗室で行われる蛍光イメージングを明環境下でも行うことが可能であることを実証し,概日リズムに応じた脳機能の変化など従来は測定困難であった条件下での脳機能測定の実現可能性を示した.

▶ 低消費電力型自己リセットセンサによる高信号対雑音比脳機能イメージング

自己リセット型イメージセンサは高い光強度下でのイメージングを可能とするため、実効的な信号対雑音比を通常のイメージセンサよりも向上させることができる. 本研究では自己リセットセンサの低消費電力化により熱起因のノイズを低減することで、通常のイメージセンサよりも信号対雑音比を 20 [dB]程度向上可能なセンサの開発に成功した.また、本センサを用いて神経活動に伴う微弱な内因性信号の可視化に成功した.特に、従来のセンサでは信号対雑音比の不足により試行平均を行うなどしなければ内因性信号の検出が困難であったところを、本研究では1回の試行で信頼性良く検出することに成功した.

▶ 埋植用フレキシブルデバイスプラットフォームの開発

埋植型イメージングデバイスの視野拡大を目的として,平坦な有機薄膜上に極めて 低背に複数の半導体素子を実装したデバイス形態を提案し,その製作プロセスを開発 した.また,開発したプロセスにより埋植可能なイメージングデバイスを試作し,脳 機能に関わる血流動態の観察に成功した.開発したデバイスは高いフレキシブル性を 示し,顕著なダメージなしに軟弱な生体組織間へ埋植可能であった.さらに,複数素 子のアレイ化や配線の多層化も実証し,今後の高い発展可能性を示した.

5.2 今後の展望

本研究で得られた知見から,以下のような展望が考えられる.

▶ 自己リセット型イメージセンサ

本研究では自己リセット方式によるダイナミックレンジ拡大と信号対雑音比向上 を実証することができたものの、特に信号対雑音比は理論値からの乖離がみられ、改 善の余地がある.リセット雑音の低減や更なる低消費電力化による熱ノイズの低減な ど、回路上の工夫が求められる.また、信号出力の線形性に歪みが見受けられるため、 より正確な測定を実現するために回路の改良やポストプロセッシングによる補正処 理が必要である.さらに、現在は実験前にキャリブレーションを行うことで通常のセ ンサと同様の脳機能測定を実現しているが、事前キャリブレーションが不要な補正理 論やノイズの低減が可能な補正理論が提案されており、今後の適用による応用範囲の 拡大が見込まれる.自己リセット型 CMOS イメージセンサはコントラスト比の高い 信号や内因性信号のような微弱信号を光学的に観察する上で有利であり、今後脳内に 限らず、小型デバイスで高分解能・広ダイナミックレンジ・高信号対雑音比のイメー ジングが要求される多様な用途での活用が期待される.

フレキシブルイメージングデバイス

本研究では、イメージセンサなどの光学素子の搭載に適し、生体内に埋植可能な防 水性、絶縁性、生体適合性を備えた、薄膜状のフレキシブル構造を持つ埋植デバイス の概念と製作プロセスを示した.試作したデバイスは期待通りの高いフレキシビリテ ィを示し、生体内への低侵襲な埋植を可能としたものの、デバイスの耐久性や長期生 体適合性などの評価は行うことができていない.生体に最適な柔軟性や埋植方法、デ バイス製作条件の最適化も済んでおらず、今後の調査・研究が必要である.一方で本 手法は複数素子のアレイ化や配線の多層化など高い応用可能性を示しており、既存の LSI 技術との組み合わせも可能であるため、比較的容易に高性能な埋植デバイスを開 発できると期待される.これにより、速いサイクルで革新的な広視野の脳機能イメー ジングデバイスやブレイン・マシン・インターフェースの開発につながり、神経科学 のより速い発展に貢献すると考えられる.また、製作プロセスはほとんどがバッチプ ロセスに対応しており、量産応用も期待できるため、用途も脳機能イメージングデバ イスに限らず、広く生体向けフレキシブルデバイスのプラットフォームとして発展す るポテンシャルがあると考える. 今後は自己リセット型イメージセンサをフレキシブルイメージングデバイスに組 み込むことで、それぞれの特徴を活かした、高信号対雑音比かつフレキシブルで侵襲 性の低い埋植型イメージングデバイスの実現が期待される.自己リセット型イメージ センサは原理的には一般的な CMOS イメージセンサの画素を自己リセット型の画素 に置き換えることのみにより実現されるので、自己リセット型イメージセンサをフレ キシブルデバイスに組み込む上で不整合は生じない.フレキシブルデバイスはセンサ 表面を撮像対象に従来よりよく密着させる効果も期待できるため、自己リセットセン サとの相乗効果により、従来の埋植デバイスでは観察が困難であった微弱な神経活動 をより高精度かつ高分解能で観察可能になると考えられる.明環境下での蛍光観察な ど、自己リセットセンサの特徴を活かした観察も依然として可能であり、幅広い実験 条件に適応可能な実用性の高い埋植デバイスが実現可能と期待される.

埋植デバイスの今後の大きな流れとしては、デバイスの完全無線化が見込まれる. 現状ではセンサや発光素子に電力を供給し、信号の送受信を行うため、埋植デバイス と体外の制御装置が有線で接続されている.しかし、生体の表皮を貫通するケーブル はウイルスや細菌にとっての生体内への侵入口となり、安全性の低下をもたらす.ま た、ケーブルにより生体の行動が制限されるため、実験に与える影響も無視できない. ケーブルにかかる応力が埋植部に伝搬し、計測部のずれや生体の損傷が生じるのも問 題である.埋植デバイスの無線化は電磁場[111]や光[112]を利用した手法が検討されつ つあり、これらのいち早い適用が望まれる.

本研究では、これまでの埋植デバイスの視野がごく狭い領域に限られ、いわば点に 近い形での観察を行っていたものを、フレキシブルデバイスによりアレイ化し、より 広い面状の観察が可能なように拡張を試みたものである.しかし、今後は脳全体を観 察するため、脳内に立体的にセンサを分散可能なシステムを考慮すべきである.脳組 織中での可視光の散乱長はおおよそ 25-100 [µm]程度であるため[113]、脳表面のみか ら脳全体を観察することは難しい.生体への侵襲性を考慮すると、脳全体に独立した 超小型の無線素子をばらまく形態が最も適している.このような素子には本研究のフ レキシブルデバイスのような基板や配線はもはや不要となる.しかし、それでも一般 に無線送電や無線通信は伝送距離が短いほど有利であり、素子の微小化と無線伝送の 効率は相反するため、脳表面にフレキシブルデバイスを用いて広い面積の高効率な無 線中継器を構成し、体外と脳内をそれぞれに適した方法でカップリングするのは理に 適った構造といえ、本研究の応用が期待される分野となる.

最後に、本研究が脳の機能的構造を明らかにする壮大な試みの一助となり、人類の 自己理解の深化や能力の拡張、計算機科学をはじめとする様々な産業応用、神経疾患 の治療法開発など、社会に幸福をもたらす技術に発展することを願ってやまないこと を述べ、本論文の結びとする.

付録

自己リセット画素回路の遷移過程と低消費電力化の方策

図 3-4 の自己リセット画素の動作について, PD の寄生容量電圧 V_{PD} が V_{dd} = 3.3 [V] から徐々に下降する過程を考える.ただし、以下において V_{dd} は電源電圧(= 3.3 [V])、 V_{ss} は Gnd 電圧(=0[V])、 $V_{GS}(X)$ 、 $V_{SG}(X)$ は MOS X のゲート・ソース間電圧、 V_{TN} およ び V_{TP} はそれぞれ n 型、p型 MOS の閾値電圧、 V_{DD} および V_{SS} はそれぞれ電源電圧、グ ランド電圧、 V_{bn} および V_{bp} はそれぞれ n 型、p型ソースフォロワのバイアス電圧、 V_{Δ} は PD の寄生容量に生じた光電子による電圧の変分である.他は図中の表記に従う.

 $V_{PD} = 3.3 [V]$ のとき、 M_{p1} および M_{p2} は常に $V_{SG}(M_{p1}) - |V_{TP}| < 0$ および $V_{SG}(M_{p2}) - |V_{TP}| < 0$ でカットオフ状態にあり、 M_{n1} は $V_{GS}(M_{n1}) - V_{TN} > 0$ で ON 状態である.したがって V_{SR} は電圧源がなく M_{n1} を介して接地された状態となり、 $V_{SR} = V_{SS}$ となる.また M_{p3} は $V_{SG}(M_{p3}) - |V_{TP}| = V_{S1} - |V_{TP}|$ となり、 $V_{S1} - |V_{TP}| > 0$ ならば ON 状態で $V_{S1} - |V_{TP}| < 0$ ならば OFF 状態となるため、 $V_{S1} \simeq |V_{TP}|$ 付近に収束する.

次に $V_{PD} = V_{dd} - |V_{TP}| = 2.6 [V] (\simeq$ リセット電圧)付近のとき、 M_{p1} は $V_{SG}(M_{p1}) - |V_{TP}| = V_{dd} - (V_{dd} - |V_{TP}|) - |V_{TP}| = 0$ となり、OFF 状態から ON 状態への遷移過程に ある. M_{n1} は $V_{GS}(M_{n1}) - V_{TN} > 0$ で ON 状態であり、 $V_{SR} = V_{SS}$ である. M_{p3} は $V_{SG}(M_{p3}) - |V_{TP}| = V_{S1} - |V_{TP}|$ となり、先程と同様に $V_{S1} = |V_{TP}|$ 付近に収束するが、 M_{p1} が半 ON 状態にあるため、 M_{p1} の抵抗値と M_{p3} の抵抗値で V_{dd} を分圧する形となり、先程より V_{S1} は高い電圧 $|V_{TP}| + V_{\alpha}$ となる. M_{p2} は $V_{SG}(M_{p2}) - |V_{TP}| = \{|V_{TP}| + V_{\alpha} - (V_{dd} - |V_{TP}|)\} - |V_{TP}| = |V_{TP}| + V_{\alpha} - V_{dd} < 0$ であるため、依然として OFF 状態である.平衡状態において、全体として電流が流れる経路はない.

 $V_{PD} = V_{dd} - |V_{TP}| - V_{\Delta} = 1.6 [V]$ 付 近 の とき , M_{p1} は $V_{SG}(M_{p1}) - |V_{TP}| = \{V_{dd} - (V_{dd} - |V_{TP}| - V_{\Delta})\} - |V_{TP}| = V_{\Delta} > 0$ となり, ON 状態となる. M_{n1} は依然 $V_{GS}(M_{n1}) - V_{TN} > 0$ で ON 状態, $V_{SR} = V_{SS}$ である. M_{p3} は $V_{SG}(M_{p3}) - |V_{TP}| = V_{S1} - |V_{TP}| > 0$ で ON 状態であるため, $M_{p1} \ge M_{p3}$ を通した経路が導通状態となり, 貫通電流が発生する. V_{S1} は先程よりさらに高い電圧 $|V_{TP}| + V_{\alpha}' \ge c$ なる. また, M_{p2} は $V_{SG}(M_{p2}) - |V_{TP}| = \{|V_{TP}| + V_{\alpha}' - (V_{dd} - |V_{TP}| - V_{\Delta})\} - |V_{TP}| = |V_{TP}| + V_{\alpha}' + V_{\Delta} - V_{dd}$ よ り $V_{\alpha}'(= V_{S1} - |V_{TP}|) > V_{dd} - |V_{TP}| - V_{\Delta}(= V_{PD})$ のとき $V_{SG} - |V_{TP}| > 0$ となり, ON 状態となる. よって, この とき M_{p1} , M_{p2} , M_{n1} も導通状態となり, 貫通電流が発生する.

最後に $V_{PD} = V_{TN} = 0.6 [V]$ 付近のとき, M_{p1} , $M_{p2} \downarrow V_{SG}(M_{p1}) - |V_{TP}| > 0$ および $V_{SG}(M_{p2}) - |V_{TP}| > 0$ で ON 状態であり, $M_{n1} \downarrow V_{GS}(M_{n1}) - V_{TN} = 0$ の半 ON 状態であ る. M_{p1} , M_{p2} の抵抗値に比べて M_{n1} の抵抗値は著しく大きいため, $V_{SR} \simeq V_{dd}$ となり V_{SR} が反転する. 同様に $V_{S1} \simeq V_{dd}$ であるから, $M_{p3} \downarrow V_{SG}(M_{p3}) - |V_{TP}| < 0$ であり OFF 状態 となる. M_{p1} , M_{p2} , M_{n1} を通してわずかに漏れ電流が生じるが, 画素全体の動作とし て自己リセットが発生しすぐにVppが高電位に再チャージされる.

以上をまとめると、貫通電流が発生する原因となっているのは、 V_{PD} が1.6 [V]付近に あるときすべての MOS が ON 状態となってしまい、 $M_{p1} \ge M_{p3}$ を通した経路および M_{p1} 、 M_{p2} 、 M_{n1} を通じた経路を通して $V_{dd} \ge V_{ss}$ が導通状態となるためである.

漏れ電流を抑止する対策としては、 $M_{p1} \geq V_{PD} = 3.3 [V] (= V_{dd})$ から $V_{PD} = 0.6 [V] (= V_{TN})$ 付近まで OFF 状態に保たせることができればよい. すなわち, $V_{SG}(M_{p1}) - |V_{TP}| = V_S(M_{p1}) - V_{G}(M_{p1}) - |V_{TP}| = V_S(M_{p1}) - V_{PD} - |V_{TP}|$ であるから、 $V_S(M_{p1}) - V_{PD} - |V_{TP}| \leq 0$ すなわち $V_S(M_{p1}) \leq V_{TN} + |V_{TP}|$ とすればよい. ただしこの $V_S(M_{p1})$ は V_{SR} の最大電圧となり、 V_{SR} は nMOS につながって画素リセットを行うので、 $V_S(M_{p1})$ はできるだけ高い電圧の方が望ましい. そこで、漏れ電流を抑止することを目的として、 $V_S(M_{p1})$ に与える電圧を V_{STI} とし、 $V_{STI} \simeq V_{TN} + |V_{TP}| \simeq 1.5 [V]$ 程度を与える構造とした.

ただし、Schmitt Trigger インバータの出力反転を起こす電圧が 1.0 [V]から 0.35 [V]程度に低下する.n型のソースフォロワおよび p型のソースフォロワはそれぞれ V_{bn} 以下および $V_{dd} - |V_{bp}|$ 以上の領域に入力電圧に不感な領域が存在するため、 V_{PD} の 最低電圧 0.35 [V]に対応させて後段の 3 段ソースフォロワを n型-p型-n型という形 から p型-n型-p型という形に変更した (図 付録-1).またこれに伴い、 V_{PD} の最大電 圧となるリセット電圧を 2.8 [V]から 2.2 [V]と従来よりも低く変更した.



図 付録-1 低消費電力型自己リセット画素回路と pnp 型 3 段ソースフォロワ A low power consumption self-reset pixel and pnp-type three-stage source followers

発表目録

【学術論文】

- Takahiro Yamaguchi, Hiroaki Takehara, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Implanrable self-reset CMOS image sensor and its application to hemodynamic response detection in living mouse brain", *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 55, no. 4S, 04EM02, March 2016. (2016 JJAP Spotlights 選出, 第 39 回応用物理学会論 文奨励賞受賞)
- Takahiro Yamaguchi, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Fluorescence imaging under background light with a self-reset CMOS image sensor", *The Journal of Engineering*, doi: 10.1049/joe.2015.0046, November 2015.
- 3. Kiyotaka Sasagawa, **Takahiro Yamaguchi**, Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, Hironari Takehara, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "An implantable CMOS image sensor with self-reset pixels for functional brain Imaging," IEEE Transaction on Electron Devices , vol. 63, no. 1, pp. 215-222, January 2016.
- 4. Yoshinori Sunaga, Hiroshi Yamaura, Makito Haruta, **Takahiro Yamaguchi**, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Yumiko Yoshimura, and Jun Ohta, "Implantable imaging device for brain functional imaging system using flavoprotein fluorescence," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 55, no. 3S2, 03DF02, January 2016.
- Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, Takahiro Yamaguchi, Hironari Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "Intrinsic signal imaging of brain function using a small implantable CMOS imaging device," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 54, no. 4S, 04DL10, March 2015.

【国際会議における発表】

- 1. **Takahiro Yamaguchi**, Hajime Hayami, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Parylene-based flexible imaging device for physiological measurement of rodent brain", IEEE Sensors 2017, Scottish Event Campus, Scotland, November 2017 (Poster).
- Takahiro Yamaguchi, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "A packaging method for an implantable brainmachine interface device with a thin film substrate", The International Conference on BioSensors, BioElectronics, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS & Applications (Bio4Apps 2016), Griffith University, Australia, December 2016 (Oral).
- 3. **Takahiro Yamaguchi**, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "A fabrication process for an implantable brainmachine interface device on a thin film substrate", GIST-NCTU-NAIST Symposium 2016, Nara Institute of Science and Technology, Japan, November 2016 (Oral).
- 4. **Takahiro Yamaguchi**, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "A fabrication process for implantable brainmachine interface devices on a thin film substrate", 2016 Taiwan-Japan Joint Symposium, Nara Institute of Science and Technology, Japan, October 2016 (Poster).
- 5. Takahiro Yamaguchi, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Improvement of power consumption and SNR of self-reset pixels for an implantable CMOS image sensor", 2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2015), Sapporo Convention Center, Japan, September 2015 (Oral).
- Takahiro Yamaguchi, Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Noise performance of an implantable self-reset CMOS image sensor", The 2014 International Meeting for Future of Electron Devices, Kansai (IEEE IMFEDK 2014), Ryukoku University, Japan, June 2014 (Poster).
- Sunaga Yoshinori, Akari Shiraishi, Takahiro Yamaguchi, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Yumiko Yoshimura, Jun Ohta, "GCaMP imaging associated with visual stimulation by implantable imaging device", Neuroscience (SfN) 2017, November 2017.
- 8. Sunaga Yoshinori, Akari Shiraishi, **Takahiro Yamaguchi**, Yasumi Ohta, Makito Haruta, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "Miniaturized-implantable device for optical imaging and stimulation", Optogenetics Research Society Japan, October 2017.
- 9. Kiyotaka Sasagawa, Makito Haruta, **Takahiro Yamaguchi**, Koki Fujimoto, Yoshinori Sunaga, Yasumi Ohta, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Implantable optoelectronic devices for measurement and control of neural functions," The 39th Annual

International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'17), July 2017.

- 10. Kiyotaka Sasagawa, Koki Fujimoto, Takahiro Yamaguchi, Makito Haruta, Yasumi Ohta, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "An ultra-thin LED light source with excitation filters for an implantable imaging devices," 9th International Conference on Molecular Electronics and bioelectronics (M&BE9), June 2017.
- 11. Kiyotaka Sasagawa, Makito Haruta, **Takahiro Yamaguchi**, Yasumi Ohta, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "A miniature imaging device using a self-reset image sensor for hemodynamic imaging," 2017 International Image Sensor Workshop (IISW), May 2017.
- 12. Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, Takahiro Yamaguchi, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "An implantable imaging device for observing the recovery process from cerebrovascular disease in small animal brains (invited)," 2016 Global Research Efforts on Energy and Nanomaterials, December 2016.
- Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Takahiro Yamaguchi, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "Highly sensitive implantable imaging device for flavoprotein fluorescence imaging," Neuroscience 2016, November 2016.
- 14. Kiyotaka Sasagawa, **Takahiro Yamaguchi**, Makito Haruta, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "Hemodynamic imaging using an implantable self-reset image sensor," The 12th IEEE BioCAS, October 2016.
- 15. Kiyotaka Sasagawa, Takahiro Yamaguchi, Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, Yasumi Ohta, Hironari Takehara, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "An implantable needle shape image sensor with an on-chip thinned LED," 2016 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2016), September 2016.
- 16. Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, Takahiro Yamaguchi, Yuji Katsuragi, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda and Jun Ohta, "Implantable micro imaging device for weak fluorescence imaging in feely moving mice," 10th FENS Forum of Neuroscience, July 2016.
- 17. Kiyotaka Sasagawa, Takahiro Yamaguchi, Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, Hironari Takehara, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "Image processing technique for an implantable image sensor with self-resetting function," Neuroscience2015 SfN 45th annual meeting, McCormick Place Convention Center, Chicago, USA, October 2015.
- 18. Yoshinori Sunaga, Hiroshi Yamaura, Makito Haruta, Takahiro Yamaguchi, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Yumiko Yoshimura and Jun Ohta, "Improvement of green fluorescence imaging system based on implantable CMOS imaging device for freely moving mice,"

Neuroscience2015 SfN 45th annual meeting, McCormick Place Convention Center, Chicago, USA, October 2015.

- 19. Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, **Takahiro Yamaguchi**, Hironari Takehara. Yasumi Ohta, Mayumi Motoyama, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta., "An implantable hemodynamic imaging device for revealing relation between a blood flow and brain activity in animal behavior," Neuroscience2015 SfN 45th annual meeting, McCormick Place Convention Center, Chicago, USA, October 2015.
- 20. Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, **Takahiro Yamaguchi**, Hironari Takehara, Yasumi Ohta, Mayumi Motoyama, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, and Jun Ohta, "An implantable hemodynamic imaging device for observing the process of recovery from cerebrovascular disease," 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, MiCo, Milano Conference Center, August 2015.
- 21. Yoshinori Sunaga, Hiroshi Yamaura, Makito Haruta, **Takahiro Yamaguchi**, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Yumiko Yoshimura and Jun Ohta, "Implantable imaging device for brain functional imaging system using flavoprotein fluorescence," M&BE8, タワーホール船 堀, June 2015.
- 22. Yoshinori Sunaga, Makito Haruta, **Takahiro Yamaguchi**, Mayumi Motoyama, Yasumi Ohta, Hiroaki Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "An implantable green fluorescence imaging device using absorption filters with high excitation light rejection ratio," Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS 2014), 1160, SwissTech Convention Center, Lausanne, Switzerland, October 2014.
- 23. Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, Takahiro Yamaguchi, Hironari Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "A multi-modal implantable CMOS imaging device with two-color light source for intrinsic signal detection in a brain," International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), D-7-3, Tsukuba International Congress Center, Sepember 2014.
- 24. Makito Haruta, Yoshinori Sunaga, **Takahiro Yamaguchi**, Hironari Takehara, Toshihiko Noda, Kiyotaka Sasagawa, Takashi Tokuda, Jun Ohta, "Development of an implantable imaging device for observation of intrinsic signals in the brain," International Conference on BioSensors, BioElectronics, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS and Applications 2013 (Bio4Apps 2013), PM-3, Tokyo Medical and Dental University, Japan, October 2013.

【国内学会における発表】

- 山口 貴大, [論文奨励賞受賞記念講演] "Implantable self-reset CMOS image sensor and its application to hemodynamic response detection in living mouse brain," 第 78 回応用 物理学会秋季学術講演会, 2017 年 9 月.
- 山口 貴大, "イメージセンサのフレキシブルデバイス応用に向けた実装法の開発," VDEC デザイナーズフォーラム 2017, 2017 年 9 月.
- 3. 山口 貴大, 速水 一, 須永 圭紀, 春田 牧人, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "薄膜を基板とする CMOS イメージングデバイスの脳機能計測に向けた 実証," フィジカルセンサ バイオ・マイクロシステム合同研究会, 2017 年 8 月.
- 山口貴大,須永 圭紀,春田 牧人,野田 俊彦,笹川 清隆,徳田 崇,太田 淳, "脳機能計測に向けた埋植型フレキシブルイメージングデバイスの開発,"LSI とシ ステムのワークショップ 2017,2017年5月.
- 5. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "無機固体素子を用いたフィルム状脳内埋植用 フレキシブルデバイスの開発," H29 年電気学会全国大会, 2017 年 3 月.
- 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "生体埋植用イメージングシステムに向けたフレキシブルデバイス," フ ィジカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同研究会, 2016 年 8 月.
- 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "ブレイン・マシン・インターフェースに向けたフレキシブルデバイス," LSI とシステムのワークショップ 2016, 2016 年 5 月.
- 8. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 元山 真由美, 太田 安美, 竹原 宏明, 野田 俊 彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "埋植用自己リセット型 CMOS イメージセン サによる内因性シグナルの検出,"応用物理学会秋季学術講演会, 2015 年 9 月.
- 9. 山口 貴大, "神経活動の検出に特化した時間微分出力 CMOS イメージセンサ," VDEC デザイナーズフォーラム 2015, 2015 年 8 月.
- 10. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "埋植用自己リセット型イメージセンサの低発熱化による SNR 向上," LSI とシステムのワークショップ 2015, 2015 年 5 月.
- 11. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "生体埋植用自己リセット型 CMOS イメージセンサ画素の低消費電力化," 応用物理学会春季学術講演会, 11p-D6-2, 2015 年 3 月.
- 12. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "明環境下における蛍光タンパク質イメージングを実現する埋植用自己 リセット型 CMOS イメージセンサ," 関西学生研究論文講演会, 2015 年 3 月.
- 13. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "自己リセット機能を備えた生体埋植用 CMOS イメージセンサの開発," 映像情報メディア学会年次大会, 20-1, 2014 年 9 月.

- 14. 山口 貴大, "自己リセット機能を備えた高 SNR 生体埋植 CMOS イメージセンサ," VDEC デザイナーズフォーラム 2014, 2014 年 8 月.
- 15. 山口 貴大, 須永 圭紀, 春田 牧人, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "自 己リセット機能を備えた高 SNR 生体埋植型イメージセンサ," 電気学会全国大会, 3-124, 2014 年 3 月.
- 16. 須永 圭紀, 白石 愛香里, 山口 貴大, 春田 牧人, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇,
 吉村 由美子, 太田 淳, "埋植型イメージングデバイスを用いた視覚刺激に伴う
 GCaMP 蛍光計測,"平成 29 年度 E 部門総合研究会, 2017 年 6 月.
- 17. 須永 圭紀, 白石 愛香里, 山口 貴大, 春田 牧人, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 吉村 由美子, 太田 淳, "GCaMP 蛍光計測用埋植型 CMOS イメージングデバイス の開発と in vivo 性能評価," 情報センシング研究会(IST), 2017 年 6 月.
- 18. 笹川 清隆,山口 貴大,春田 牧人,太田 安美,野田 俊彦,徳田 崇,太田 淳, "生体イメージングに向けた埋植型高実効 SNR イメージセンサ,"光応用電磁界 計測 (PEM)時限研究専門委員会,2017年2月.
- 19. 須永 圭紀,春田 牧人,山口 貴大,桂木 優治,竹原 宏明,野田 俊彦,笹川 清隆, 徳田 崇,太田 淳,"埋植型イメージングデバイスの高画質化に向けた光学系の改 善,"LSI とシステムのワークショップ 2016, 2016 年 5 月.
- 20. 須永 圭紀, 春田 牧人, 山口 貴大, 桂木 優治, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "埋植型デバイスによる広範囲イメージングに向けた励起光除 去性能改善," 応用物理学会春季学術講演会, 20p-W331-5, 2016 年 3 月.
- 21. 須永 圭紀,山浦 洋,春田 牧人,山口 貴大,元山 真由美,太田 安美,竹原 宏明, 野田 俊彦,笹川 清隆,徳田 崇,吉村 由美子,太田 淳,"埋植型 CMOS デバイス を用いたフラビン蛋白蛍光イメージング,"応用物理学会秋季学術講演会,2015 年 9月.
- 22. 春田 牧人, 須永 圭紀, 山口 貴大, 竹原 浩成 太田 安美, 元山 真由美, 竹原 宏明, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "埋め込み可能な小型脳血流イメージングデバイスの開発," E 部門総合研究会, 2015 年 7 月.
- 23. 須永 圭紀, 春田 牧人, 山口 貴大, 元山 真由美, 太田 安美, 竹原 宏明, 野田 俊 彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "脳機能計測に向けた緑色蛍光観察用埋植型 CMOS イメージングデバイスの性能評価," バイオ・マイクロシステム研究会, BMS-15-005, 2015 年 3 月.
- 24. 須永 圭紀,春田 牧人,山口 貴大,元山 真由美,太田 安美,竹原 宏明,野田 俊 彦,笹川 清隆,徳田 崇,太田 淳,"自由行動下脳機能計測に向けた緑色蛍光観察 用埋植型イメージングデバイス,"応用物理学会関西支部 平成 26 年度第3回講演 会「関西発グリーンエレクトロニクス研究の進展」,2015 年 2 月.
- 25. 春田 牧人, 須永 圭紀, 山口 貴大, 竹原 浩成, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "行動実験を目的とした埋植用 CMOS イメージングデバイスによる脳機 能イメージング," 日本神経科学大会(Neuroscience2014), P2-397, 2014 年 9 月.

- 26. 春田 牧人, 須永 圭紀, 山口 貴大, 野田 俊彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "生 体埋植 CMOS イメージングデバイスを用いた血流計測による自由行動下脳機能 イメージング,"応用物理学会春季学術講演会, 18p-E15-4, 2014 年 3 月.
- 27. 須永 圭紀, 春田 牧人, 竹原 浩成, 山口 貴大, 元山 真由美, 太田 安美, 野田 俊 彦, 笹川 清隆, 徳田 崇, 太田 淳, "生体埋植型 CMOS イメージングデバイスの 緑色蛍光検出感度改善," バイオ・マイクロシステム研究会, BMS-14-5, 2014 年 3 月.
- 28. 須永 圭紀, 春田 牧人, 山口 貴大, 元山 真由美, 太田 安美, 野田 俊彦, 笹川 清 隆, 徳田 崇, 太田 淳, "生体埋植型 CMOS イメージングデバイスに向けた緑色蛍 光観察用フィルタの開発," 関西学生研究論文講演会, 2014 年 3 月.

【受賞等】

- 1. 応用物理学会論文奨励賞, 第 39 回応用物理学会論文賞, 2017 年 9 月.
- 2. 奨励賞, VDEC デザイナーズフォーラム 2017, 2017 年 9 月.
- 3. **IEEE SSCS Kansai Chapter Academic Research Award**, LSI とシステムのワークショップ 2016, 2016 年 5 月.
- 4. 嘱望賞, VDEC デザイナーズフォーラム 2015, 2015 年 8 月.
- 5. 優秀講演賞,日本光学会第13回関西学生研究論文講演会,2015年3月.
- 6. 優秀賞, VDEC デザイナーズフォーラム 2014, 2014 年 8 月.
- 7. **Student Paper Award**, The 2014 International Meeting for Future of Electron Devices, Kansai (IEEE IMFEDK2014), 2014 年 6 月
- 8. 日本学術振興会特別研究員(DC2) 採択, 2016年度 2017年度.
- 9. 公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団奨学生 採択, 2015 年度.

謝辞

本研究は奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 光機能素子科学研究 室において,太田淳教授の5年間に亘る厳しくも温かいご指導の下に遂行されました. 太田淳教授には主指導教官として,研究方針や実験手法,行き詰った時の重要なご提 言,研究者としての心構えに至るまで,懇切丁寧なご指導を頂きました.ここに深く 感謝申し上げます.

同研究科 情報機能素子科学研究室 浦岡行治教授には,副指導教官として,本研究 を遂行する上で有益なご提言やご指導を賜りました.ここに深く御礼申し上げます.

同研究科 生体プロセス工学研究室 細川陽一郎教授には,スーパーバイザーとして, 本研究を遂行する上で有益なご提言やご指導,共同研究のご提案を賜りました.ここ に深く御礼申し上げます.

同研究室 徳田崇准教授には,研究における姿勢や多様な観点からの考察・ご提言 をはじめ,多岐にわたるご指導を頂きました.ここに深く感謝申し上げます.

同研究室 笹川清隆助教には、本研究を遂行する上で直接ご指導を頂き、豊富な知識と経験をもとに研究方針や実験手法、実験結果の考察に至るまで熱心なご指導と議論を頂きました.5年に亘る研究活動を遂行できたのも笹川清隆助教のご指導あってのものと、ここに深く感謝申し上げます.

同研究室 野田俊彦助教には,研究を遂行するにあたり,豊富な知識と経験をもと に多岐にわたるご指導・ご提言を頂きました.特に第4章の執筆にあたってはプロセ ス技術をはじめとして熱心なご指導を頂きました.ここに深く感謝申し上げます.

東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 一木研究室 竹原宏明助教には, 光機能素子科学研究室において特任助教として着任されていた間に直接ご指導を頂 き,豊富な知識と経験をもとに多岐にわたるご指導・ご提言を頂きました.ここに深 く感謝申し上げます.

同研究室 春田牧人特任助教には,豊富な知識と経験をもとに多岐にわたるご指導・ ご提言を頂きました.特に動物実験やデバイス開発に関連する実験方針の策定や考察 には数多くの刺激的なご提言・議論を頂きました.また,時には指導者として,時に は友人のように身近な先輩として,公私に亘りご助力を頂きました.ここに深く感謝 申し上げます.

同研究室研究員太田安美博士には、動物実験を中心として多岐にわたるご指導・ ご提言を頂きました.特に第2章を執筆するにあたっては重要なご提言・ご助力を頂 きました.ここに深く感謝申し上げます.

同研究室研究員 竹原浩成博士には、センサ設計やプロセス技術をはじめとして常 日頃から数多くのご指導・ご提言、刺激的な議論を頂きました.ここに深く感謝申し 上げます.

同研究室 研究員 須永圭紀博士には、研究全般にわたって多岐にわたるご指導・ご

提言を頂きました.頼れる先輩として常に見本を示して頂き,ここに深く感謝申し上 げます.

同研究室研究員 野田佳子氏,河原麻実子氏,元研究員 元山真由美氏,蜂須賀亜依 氏には,プロセス技術や動物実験に関するご指導をはじめ,多くのご助力を頂きました.ここに深く感謝申し上げます.

同研究室 秘書 福澤享子氏,元秘書 松本和美氏には,研究活動に伴う諸手続きを はじめ親身にご相談やご助力を頂き,円滑な研究環境をつくりだして頂きました.こ こに深く感謝申し上げます.

同研究室 博士課程3年 速水一氏,藤沢匠氏には,同期として5年間に亘り日頃か ら深い議論を頂き,また良き友人として公私にわたってご助力を頂きました.ここに 深く感謝申し上げます.

同研究室の先輩,同期,後輩の皆様とは,互いに助け合い,公私にわたって良い刺激を受けるとともに,多くのご助言や議論の機会を頂き,実りある学生生活を送ることができました.平坦ではなかった研究生活を乗り切れたのも,皆様の大きな支えあってのものでした.ここに深く感謝申し上げます.

豊田工業大学 工学部 マイクロメカトロニクス研究室 佐々木実教授には,学士卒 業研究の主指導教官としてだけでなく,大学院での研究についてもプロセス開発を中 心として甚大なご指導・ご協力を頂きました.特に第4章の執筆にあたっては共同研 究のご提案をはじめ数多くの重要な示唆を頂きました.ここに深く感謝申し上げます.

情報通信研究機構 脳情報通信融合研究室 鈴木隆文室長には,第4章の研究を開始 するにあたって議論の機会を頂き,重要な示唆を頂きました.ここに深く感謝申し上 げます.

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 Rogers Research Group, John A. Rogers 教授 と研究室の皆様には、フレキシブルエレクトロニクスの素人であった私を研究室に受 け入れ、貴重な研究の機会を与えて頂きました. 第4章を執筆するにあたって重要な 知見を得ただけでなく、異文化に浸った刺激的な時間を頂きました. ここに深く感謝 申し上げます.

チップ試作にあたり、ご協力いただいた半導体理工学研究センター(STARC)、東 京大学大規模集積センター、株式会社凸版テクニカルデザインセンターに心から感謝 致します.

研究活動費,関連費においては,公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団および日本学術振興会(課題番号 26249051,15K01289,15K21164,16J11518),立石科学技術振興財団からのご支援を頂戴しました.心から感謝致します.

本研究で犠牲となった実験動物たちに、身を尽くしての科学技術への貢献に、心よりの感謝と、深い哀悼の意を表します.

最後に,5年間に亘る大学院での研究に理解を示し,身心ともに支えて頂きました 家族に深く感謝致します.

参考文献

- [1] M. F. Bear, B. W. Connors, and M. A. Paradiso, (加藤宏司,後藤薫,藤井聡,山崎 良彦 訳),神経科学 脳の探求,初版第2刷. 西村書店, 2009.
- [2] J.-C. Rah, L. Feng, S. Druckmann, H. Lee, and J. Kim, "From a meso- to micro-scale connectome: array tomography and mGRASP," *Front. Neuroanat.*, vol. 9, pp. 1–12, 2015.
- [3] D. H. O'Connor, D. Huber, and K. Svoboda, "Reverse engineering the mouse brain," *Nature*, vol. 461, no. 7266, pp. 923–929, 2009.
- [4] P. G. Allen and F. S. Collins, "Toward the final frontier: The human brain," *The Wall Street Journal*, 2013.
- [5] F. A. C. Azevedo, L. R. B. Carvalho, L. T. Grinberg, J. M. Farfel, R. E. L. Ferretti, R. E. P. Leite, W. J. Filho, R. Lent, and S. Herculano-Houzel, "Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain," *J. Comp. Neurol.*, vol. 513, no. 5, pp. 532–541, 2009.
- [6] G. Buzsáki, "Neural Syntax: Cell Assemblies, Synapsembles, and Readers," *Neuron*, vol. 68, no. 3, pp. 362–385, 2010.
- [7] L. Roux, E. Stark, L. Sjulson, and G. Buzsáki, "In vivo optogenetic identification and manipulation of GABAergic interneuron subtypes," *Curr. Opin. Neurobiol.*, vol. 26, pp. 88–95, 2014.
- [8] J. P. Seymour, F. Wu, K. D. Wise, and E. Yoon, "State-of-the-art MEMS and microsystem tools for brain research," *Microsystems Nanoeng.*, vol. 3, pp. 1–16, 2017.
- [9] D. J. Brenner and E. J. Hall, "Computed tomography--an increasing source of radiation exposure," *N. Engl. J. Med.*, vol. 357, no. 22, pp. 2277–2284, 2007.
- [10] M. D. Fox and M. E. Raichle, "Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging," *Nat. Rev. Neurosci.*, vol. 8, no. 9, pp. 700–711, 2007.
- [11] D. H. S. Silverman, G. W. Small, C. Y. Chang, C. S. Lu, M. A. K. de Aburto, W. Chen, J. Czernin, S. I. Rapoport, P. Pietrini, G. E. Alexander, M. B. Schapiro, W. J. Jagust, J. M. Hoffman, K. A. Welsh-Bohmer, A. Alavi, C. M. Clark, E. Salmon, M. J. de Leon, R. Mielke, J. L. Cummings, A. P. Kowell, S. S. Gambhir, C. K. Hoh, and M. E. Phelps, "Positron emission tomography in evaluation of dementia," *JAMA*, vol. 286, no. 17, p. 2120, 2001.
- [12] J. P. Culver, A. M. Siegel, J. J. Stott, and D. A. Boas, "Volumetric diffuse optical tomography of brain activity," *Opt. Lett.*, vol. 28, no. 21, p. 2061, 2003.
- [13] K. Ohki, S. Chung, Y. H. Ch, P. Kara, and R. C. Reid, "Functional imaging with cellular resolution reveals precise micro- architecture in visual cortex," *Nature*, vol.

433, no. 7026, pp. 597–603, 2005.

- [14] A. Miyawaki, "Fluorescence imaging of physiological activity in complex systems using GFP-based probes," *Curr. Opin. Neurobiol.*, vol. 13, no. 5, pp. 591–596, 2003.
- [15] R. P. Haugland, Handbook of Fluorescent Probes and Research, 9th editio. Molecular Probes, Inc, 2002.
- [16] A. Grinvald, E. Lieke, R. D. Frostig, C. D. Gilbert, and T. N. Wiesel, "Functional architecture of cortex revealed by optical imaging of intrinsic signals," *Nature*, vol. 324, no. 6095, pp. 361–364, 1986.
- [17] S. Zhang and T. H. Murphy, "Imaging the impact of cortical microcirculation on synaptic structure and sensory-evoked hemodynamic responses in vivo," *PLoS Biol.*, vol. 5, no. 5, pp. 1152–1167, 2007.
- [18] I. Ferezou, S. Bolea, and C. C. H. Petersen, "Visualizing the cortical representation of whisker touch: voltage-sensitive dye imaging in freely moving mice," *Neuron*, vol. 50, no. 4, pp. 617–29, 2006.
- [19] F. Helmchen, M. S. Fee, D. W. Tank, and W. Denk, "A miniature head-mounted twophoton microscope: High-resolution brain imaging in freely moving animals," *Neuron*, vol. 31, no. 6, pp. 903–912, 2001.
- [20] A. D. Mehta, J. C. Jung, B. A. Flusberg, and M. J. Schnitzer, "Fiber optic in vivo imaging in the mammalian nervous system," *Curr. Opin. Neurobiol.*, vol. 14, no. 5, pp. 617–628, 2004.
- [21] B. A. Flusberg, E. D. Cocker, W. Piyawattanametha, J. C. Jung, E. L. M. Cheung, and M. J. Schnitzer, "Fiber-optic fluorescence imaging," *Nat. Methods*, vol. 2, no. 12, pp. 941–950, 2005.
- [22] J. H. Park, J. Platisa, J. V Verhagen, S. H. Gautam, A. Osman, D. Kim, V. A. Pieribone, and E. Culurciello, "Head-mountable high speed camera for optical neural recording.," *J. Neurosci. Methods*, vol. 201, no. 2, pp. 290–5, 2011.
- [23] K. K. Ghosh, L. D. Burns, E. D. Cocker, A. Nimmerjahn, Y. Ziv, A. El Gamal, and M. J. Schnitzer, "Miniaturized integration of a fluorescence microscope," *Nat. Methods*, vol. 8, no. 10, pp. 871–8, 2011.
- [24] J. H. Jennings, R. L. Ung, S. L. Resendez, A. M. Stamatakis, J. G. Taylor, J. Huang, K. Veleta, P. A. Kantak, M. Aita, K. Shilling-Scrivo, C. Ramakrishnan, K. Deisseroth, S. Otte, and G. D. Stuber, "Visualizing hypothalamic network dynamics for appetitive and consummatory behaviors," *Cell*, vol. 160, no. 3, pp. 516–527, 2015.
- [25] J. Ohta, Y. Ohta, H. Takehara, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, M. Haruta, T. Kobayashi, Y. M. Akay, and M. Akay, "Implantable microimaging device for observing brain activities of rodents," *Proc. IEEE*, vol. 105, no. 1, pp. 158–166, 2017.
- [26] 田川礼人, "脳深部神経活動イメージング用埋込型高機能CMOSセンサに関する 研究," Ph. D. thesis, 奈良先端科学技術大学院大学, 2010.

- [27] 橘本,力,"埋込型脳機能計測CMOSセンサの高画質化・低侵襲化に関する研究," Master's thesis,奈良先端科学技術大学院大学,2013.
- [28] 春田牧人,"自由行動実験における脳機能計測を可能とする超小型CMOSイメージングデバイスに関する研究,"Ph. D. thesis,奈良先端科学技術大学院大学,2014.
- [29] 須永圭紀,"自由行動下マウスの脳神経活動計測に向けた蛍光計測用埋植型 CMOSイメージングデバイスの高感度化に関する研究," Ph. D. thesis,奈良先端 科学技術大学院大学,2017.
- [30] P. K. Campbell, K. E. Jones, R. J. Huber, K. W. Horch, and R. A. Normann, "A silicon-based, three-dimensional neural interface: Manufacturing processes for an intracortical electrode array," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 38, no. 8, pp. 758–768, 1991.
- [31] R. Bhandari, S. Negi, and F. Solzbacher, "Wafer-scale fabrication of penetrating neural microelectrode arrays," *Biomed. Microdevices*, vol. 12, no. 5, pp. 797–807, 2010.
- [32] J. P. Donoghue, "Connecting cortex to machines: Recent advances in brain interfaces," *Nat. Neurosci.*, vol. 5, no. 11s, pp. 1085–1088, 2002.
- [33] S. Ogawa, T. M. Lee, A. R. Kay, and D. W. Tank, "Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation.," *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, vol. 87, no. 24, pp. 9868–72, 1990.
- [34] S. Ogawa, D. W. Tank, R. Menon, J. M. Ellermann, S. G. Kim, H. Merkle, and K. Ugurbil, "Intrinsic signal changes accompanying sensory stimulation: Functional brain mapping with magnetic resonance imaging," *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, vol. 89, no. 13, pp. 5951–5955, 1992.
- [35] S. Okawa, T. Hirasawa, T. Kushibiki, and M. Ishihara, "Quantitative Photoacoustic Imaging of The Distribution of The Optical Properties in Biological Medium," 日本レ ーザー医学会誌, vol. 35, no. 2, pp. 140–150, 2014.
- [36] K. Maslov, H. F. Zhang, S. Hu, and L. V. Wang, "Optical-resolution photoacoustic microscopy for in vivo imaging of single capillaries," *Opt. Lett.*, vol. 33, no. 9, p. 929, 2008.
- [37] D. H. Lim, M. H. Mohajerani, J. Ledue, J. Boyd, S. Chen, and T. H. Murphy, "In vivo large-scale cortical mapping using channelrhodopsin-2 stimulation in transgenic mice reveals asymmetric and reciprocal relationships between cortical areas," *Front. Neural Circuits*, vol. 6, p. 11, 2012.
- [38] D. A. Dombeck, A. N. Khabbaz, F. Collman, T. L. Adelman, and D. W. Tank, "Imaging large-scale neural activity with cellular resolution in awake, mobile mice," *Neuron*, vol. 56, no. 1, pp. 43–57, 2007.
- [39] D. J. Wallace, S. M. zum Alten Borgloh, S. Astori, Y. Yang, M. Bausen, S. Kügler, A.E. Palmer, R. Y. Tsien, R. Sprengel, J. N. D. Kerr, W. Denk, and M. T. Hasan, "Single-
spike detection in vitro and in vivo with a genetic Ca2+ sensor," *Nat. Methods*, vol. 5, no. 9, pp. 797–804, 2008.

- [40] M. B. Ahrens, M. B. Orger, D. N. Robson, J. M. Li, and P. J. Keller, "Whole-brain functional imaging at cellular resolution using light-sheet microscopy," *Nat. Methods*, vol. 10, no. 5, pp. 413–20, 2013.
- [41] M. Tohmi, H. Kitaura, S. Komagata, M. Kudoh, and K. Shibuki, "Enduring critical period plasticity visualized by transcranial flavoprotein imaging in mouse primary visual cortex," *J. Neurosci.*, vol. 26, no. 45, pp. 11775–11785, 2006.
- [42] Y. Sunaga, H. Yamaura, M. Haruta, T. Yamaguchi, M. Motoyama, Y. Ohta, H. Takehara, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, Y. Yoshimura, and J. Ohta, "Implantable imaging device for brain functional imaging system using flavoprotein fluorescence," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 55, no. 3, 2016.
- [43] Y. B. Sirotin, E. M. C. Hillman, C. Bordier, and A. Das, "Spatiotemporal precision and hemodynamic mechanism of optical point spreads in alert primates," *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, vol. 106, no. 43, pp. 18390–5, 2009.
- [44] T. Yamada, S. Umeyama, and K. Matsuda, "Separation of fNIRS signals into functional and systemic components based on differences in hemodynamic modalities," *PLoS One*, vol. 7, no. 11, 2012.
- [45] 黒田隆男, イメージセンサの本質と基礎. コロナ社, 2012.
- [46] T. Kobayashi, M. Motoyama, H. Masuda, Y. Ohta, M. Haruta, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, H. Tamura, Y. Ishikawa, S. Shiosaka, and J. Ohta, "Novel implantable imaging system for enabling simultaneous multiplanar and multipoint analysis for fluorescence potentiometry in the visual cortex," *Biosens. Bioelectron.*, vol. 38, no. 1, pp. 321–330, 2012.
- [47] S. M. Reppert and D. R. Wever, "Coordination of circadian timing system," *Nature*, vol. 418, pp. 935–941, 2002.
- [48] W. J. Kim, L. Y. Jan, and Y. N. Jan, "Contribution of visual and circadian neural circuits to memory for prolonged mating induced by rivals," *Nat. Neurosci.*, vol. 15, no. 6, pp. 876–83, 2012.
- [49] M. H. Hastings and M. Goedert, "Circadian clocks and neurodegenerative diseases: time to aggregate?," *Curr. Opin. Neurobiol.*, vol. 23, no. 5, pp. 880–7, 2013.
- [50] G. Storm, R. Henderson, J. E. D. Hurwitz, D. Renshaw, K. Findlater, and M. Purcell,
 "Extended dynamic range from a combined linear-logarithmic CMOS image sensor," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 41, no. 9, pp. 2095–2106, 2006.
- [51] O. Yadid-Pecht and E. R. Fossum, "Wide intrascene dynamic range CMOS APS using dual sampling," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 44, no. 10, pp. 1721–1723, 1997.
- [52] L. G. McIlrath, "A low-power low-noise ultrawide-dynamic-range CMOS imager with pixel-parallel A/D conversion," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 36, no. 5, pp. 846–

853, 2001.

- [53] D. X. D. Yang and A. El Gamal, "Comparative analysis of SNR for image sensors with enhanced dynamic range," in *Proc. SPIE 3649, Sensors, Cameras, and Systems for Scientific/Industrial Applications*, 1999, pp. 197–211.
- [54] N. Akahane, R. Ryuzaki, S. Adachi, K. Mizobuchi, and S. Sugawa, "A 200dB dynamic range iris-less CMOS image sensor with lateral overflow integration capacitor using hybrid voltage and current readout operation," in 2006 IEEE International Solid State Circuits Conference - Digest of Technical Papers, 2006, pp. 1161–1170.
- [55] T. Yamaguchi, Y. Sunaga, M. Haruta, M. Motoyama, Y. Ohta, H. Takehara, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, and J. Ohta, "Fluorescence imaging under background light with a self-reset complementary metal–oxide–semiconductor image sensor," *J. Eng.*, vol. 1, no. 1, 2015.
- [56] K. Sasagawa, T. Yamaguchi, M. Haruta, Y. Sunaga, H. Takehara, H. Takehara, T. Noda, T. Tokuda, and J. Ohta, "An implantable CMOS image sensor with self-reset pixels for functional brain imaging," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 63, no. 1, pp. 215–222, 2016.
- [57] S. Kavusi and A. El Gamal, "Quantitative study of high-dynamic-range image sensor architectures," in *Electronic Imaging 2004*, 2004, pp. 264–275.
- [58] A. Bermak, A. Bouzerdoum, and K. Eshraghian, "A vision sensor with on-pixel ADC and in-built light adaptation mechanism," *Microelectronics J.*, vol. 33, no. 12, pp. 1091–1096, 2002.
- [59] J. Yuan, H. Y. Chan, S. W. Fung, and B. Liu, "An activity-triggered 95.3 dB DR -75.6 dB THD CMOS imaging sensor with digital calibration," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 44, no. 10, pp. 2834–2843, 2009.
- [60] D. Park, J. Rhee, and Y. Joo, "A wide dynamic-range CMOS image sensor using selfreset technique," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 28, no. 10, pp. 890–892, 2007.
- [61] S. Koppa, D. Park, Y. Joo, and S. Jung, "A 105.6dB DR and 65dB peak SNR self-reset CMOS image sensor using a Schmitt trigger circuit," in *Midwest Symposium on Circuits and Systems*, 2011.
- [62] J. Nakamura, *Image sensors and signal processing for digital still cameras*. CRC Press, 2005.
- [63] J. Ohta, Smart CMOS image sensors and applications. CRC Press, 2008.
- [64] B. A. Flusberg, A. Nimmerjahn, E. D. Cocker, E. A. Mukamel, R. P. J. Barretto, T. H. Ko, L. D. Burns, J. C. Jung, and M. J. Schnitzer, "High-speed, miniaturized fluorescence microscopy in freely moving mice," *Nat. Methods*, vol. 5, no. 11, pp. 935–938, 2008.
- [65] H. Takehara, A. Nagaoka, J. Noguchi, T. Akagi, H. Kasai, and T. Ichiki, "Lab-on-abrain: Implantable micro-optical fluidic devices for neural cell analysis in vivo," *Sci.*

Rep., vol. 4, pp. 1–6, 2014.

- [66] M. Mank, A. F. Santos, S. Direnberger, T. D. Mrsic-Flogel, S. B. Hofer, V. Stein, T. Hendel, D. F. Reiff, C. Levelt, A. Borst, T. Bonhoeffer, M. Hubener, and O. Griesbeck, "A genetically encoded calcium indicator for chronic in vivo two-photon imaging," *Nat. Methods*, vol. 5, no. 9, pp. 805–811, 2008.
- [67] H. Tsutsui, S. Karasawa, Y. Okamura, and A. Miyawaki, "Improving membrane voltage measurements using FRET with new fluorescent proteins," *Nat. Methods*, vol. 5, no. 8, pp. 683–685, 2008.
- [68] T. Yamaguchi, Y. Sunaga, M. Haruta, H. Takehara, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, and J. Ohta, "Improvement of power consumption and SNR of self-reset pixels for an implantable CMOS image sensor," in *Extended Abstracts of the 2015 International Conference on Solid State Devices and Materials*, 2015, pp. 818–819.
- [69] T. Yamaguchi, H. Takehara, Y. Sunaga, M. Haruta, M. Motoyama, Y. Ohta, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, and J. Ohta, "Implantable self-reset CMOS image sensor and its application to hemodynamic response detection in living mouse brain," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 55, no. 4, 2016.
- [70] D. Attwell, A. M. Buchan, S. Charpak, M. Lauritzen, B. A. MacVicar, and E. A. Newman, "Glial and neuronal control of brain blood flow," *Nature*, vol. 468, no. 7321, pp. 232–243, 2010.
- [71] S. Dimitrijev, Understanding semiconductor devices. Oxford University Press, 2000.
- [72] M. Haruta, C. Kitsumoto, Y. Sunaga, H. Takehara, T. S. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, and J. Ohta, "An implantable CMOS device for blood-flow imaging during experiments on freely moving rats," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 53, no. 4 SPEC. ISSUE, 2014.
- [73] A. Bhandari, F. Krahmer, and R. Raskar, "On unlimited sampling," in 2017 International Conference on Sampling Theory and Applications (SampTA), 2017, pp. 31–35.
- [74] M. Cucuringu and H. Tyagi, "On denoising modulo 1 samples of a function," *arXiv Prepr. arXiv1710.10210*, pp. 1–25, 2017.
- [75] R. Aronoff, F. Matyas, C. Mateo, C. Ciron, B. Schneider, and C. C. H. Petersen,
 "Long-range connectivity of mouse primary somatosensory barrel cortex," *Eur. J. Neurosci.*, vol. 31, no. 12, pp. 2221–2233, 2010.
- [76] V. Sreenivasan, A. Kyriakatos, C. Mateo, D. Jaeger, and C. C. H. Petersen, "Parallel pathways from whisker and visual sensory cortices to distinct frontal regions of mouse neocortex," *Neurophotonics*, vol. 4, no. 3, p. 31203, 2016.
- [77] T. Hirabayashi, D. Takeuchi, K. Tamura, and Y. Miyashita, "Microcircuits for hierarchical elaboration of object coding across primate temporal areas," vol. 29, pp. 191–195, 2013.

- [78] A. H. Marblestone, B. M. Zamft, Y. G. Maguire, M. G. Shapiro, T. R. Cybulski, J. I. Glaser, D. Amodei, P. B. Stranges, R. Kalhor, D. a Dalrymple, D. Seo, E. Alon, M. M. Maharbiz, J. M. Carmena, J. M. Rabaey, E. S. Boyden, G. M. Church, and K. P. Kording, "Physical principles for scalable neural recording," *Front. Comput. Neurosci.*, vol. 7, p. 137, 2013.
- [79] P. J. Rousche and R. A. Normann, "Chronic intracortical microstimulation (ICMS) of cat sensory cortex using the Utah intracortical electrode array," *IEEE Trans. Rehabil. Eng.*, vol. 7, no. 1, pp. 56–68, 1999.
- [80] J. Scholvin, J. P. Kinney, J. G. Bernstein, C. Moore-Kochlacs, N. Kopell, N. Kopell, C. G. Fonstad, and E. S. Boyden, "Close-packed silicon microelectrodes for scalable spatially oversampled neural recording," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 63, no. 1, pp. 120–130, 2016.
- [81] B. Rubehn, C. Bosman, R. Oostenveld, P. Fries, and T. Stieglitz, "A MEMS-based flexible multichannel ECoG-electrode array," *J. Neural Eng.*, vol. 6, no. 3, 2009.
- [82] H. Toda, T. Suzuki, H. Sawahata, K. Majima, Y. Kamitani, and I. Hasegawa,
 "Simultaneous recording of ECoG and intracortical neuronal activity using a flexible multichannel electrode-mesh in visual cortex," *Neuroimage*, vol. 54, no. 1, pp. 203–12, 2011.
- [83] D. Khodagholy, J. N. Gelinas, T. Thesen, W. Doyle, O. Devinsky, G. G. Malliaras, and G. Buzsáki, "NeuroGrid: Recording action potentials from the surface of the brain," *Nat. Neurosci.*, vol. 18, no. 2, pp. 310–315, 2015.
- [84] J. G. McCall, T. Kim, G. Shin, X. Huang, Y. H. Jung, R. Al-Hasani, F. G. Omenetto, M. R. Bruchas, and J. A. Rogers, "Fabrication and application of flexible, multimodal light-emitting devices for wireless optogenetics," *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2413–28, 2013.
- [85] J. Kim, A. Banks, Z. Xie, S. Y. Heo, P. Gutruf, J. W. Lee, S. Xu, K. I. Jang, F. Liu, G. Brown, J. Choi, J. H. Kim, X. Feng, Y. Huang, U. Paik, and J. A. Rogers,
 "Miniaturized flexible electronic systems with wireless power and near-field communication capabilities," *Adv. Funct. Mater.*, vol. 25, no. 30, pp. 4761–4767, 2015.
- [86] K. Okabe, H. Jeewan, S. Yamagiwa, T. Kawano, M. Ishida, and I. Akita, "Co-design method and wafer-level packaging technique of thin-film flexible antenna and silicon CMOS rectifier chips for wireless-powered neural interface systems," *Sensors*, vol. 15, no. 12, pp. 31821–31832, 2015.
- [87] R.-H. Kim, S. Kim, Y. M. Song, H. Jeong, T. Kim, J. Lee, X. Li, K. D. Choquette, and J. A. Rogers, "Flexible vertical light emitting diodes," *Small*, vol. 8, no. 20, pp. 3123– 8, 2012.
- [88] D. C. Rodger, J. D. Weiland, M. S. Humayun, and Y. Tai, "Scalable high lead-count parylene package for retinal prostheses," vol. 117, pp. 107–114, 2006.

- [89] W. Li, D. C. Rodger, E. Meng, J. D. Weiland, M. S. Humayun, and Y. Tai, "Waferlevel parylene packaging with integrated RF electronics for wireless retinal prostheses," vol. 19, no. 4, pp. 735–742, 2010.
- [90] F. Axisa, D. Brosteaux, E. De Leersnyder, F. Bossuyt, J. Vanfleteren, B. Hermans, and R. Puers, "Biomedical stretchable systems using mid based stretchable electronics technology," *Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. - Proc.*, pp. 5687–5690, 2007.
- [91] R.-H. Kim, D.-H. Kim, J. Xiao, B. H. Kim, S.-I. Park, B. Panilaitis, R. Ghaffari, J. Yao, M. Li, Z. Liu, V. Malyarchuk, D. G. Kim, A.-P. Le, R. G. Nuzzo, D. L. Kaplan, F. G. Omenetto, Y. Huang, Z. Kang, and J. A. Rogers, "Waterproof AlInGaP optoelectronics on stretchable substrates with applications in biomedicine and robotics," *Nat. Mater.*, vol. 9, no. 11, pp. 929–37, 2010.
- [92] H.-J. Chung, M. S. Sulkin, J.-S. Kim, C. Goudeseune, H.-Y. Chao, J. W. Song, S. Y. Yang, Y.-Y. Hsu, R. Ghaffari, I. R. Efimov, and J. A. Rogers, "Stretchable, multiplexed pH sensors with demonstrations on rabbit and human hearts undergoing ischemia.," *Adv. Healthc. Mater.*, vol. 3, no. 1, pp. 59–68, 2014.
- [93] T. Stieglitz, M. Schuettler, and J. Meyer, "Micromachined, polyimide-based devices for flexible neural interfaces," *Biomed. Microdevices*, vol. 2, no. 4, pp. 283–294, 2000.
- [94] J. Liu, T.-M. Fu, Z. Cheng, G. Hong, T. Zhou, L. Jin, M. Duvvuri, Z. Jiang, P. Kruskal, C. Xie, Z. Suo, Y. Fang, and C. M. Lieber, "Syringe-injectable electronics," *Nat. Nanotechnol.*, vol. 10, no. 7, pp. 629–636, 2015.
- [95] K. Fukuda, Y. Takeda, Y. Yoshimura, R. Shiwaku, L. T. Tran, T. Sekine, M. Mizukami, D. Kumaki, and S. Tokito, "Fully-printed high-performance organic thin-film transistors and circuitry on one-micron-thick polymer films," *Nat. Commun.*, vol. 5, p. 4147, 2014.
- [96] S. Takeuchi, D. Ziegler, Y. Yoshida, K. Mabuchi, and T. Suzuki, "Parylene flexible neural probes integrated with microfluidic channels," *Lab on a chip*, vol. 5, no. 5. pp. 519–23, 2005.
- [97] J. H. Lee, H. S. Kim, J. H. Kim, and S.-H. Lee, "Soft implantable microelectrodes for future medicine: prosthetics, neural signal recording and neuromodulation," *Lab Chip*, vol. 16, pp. 959–976, 2016.
- [98] Y. Sun, S. P. Lacour, R. A. Brooks, N. Rushton, J. Fawcett, and R. E. Cameron, "Assessment of the biocompatibility of photosensitive polyimide for implantable medical device use," *J. Biomed. Mater. Res. Part A*, vol. 90A, no. 3, pp. 648–655, 2009.
- [99] C. Hassler, R. P. Von Metzen, P. Ruther, and T. Stieglitz, "Characterization of parylene C as an encapsulation material for implanted neural prostheses," *J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater.*, vol. 93, no. 1, pp. 266–274, 2010.
- [100] D.-H. Kim, N. Lu, R. Ghaffari, Y.-S. Kim, S. P. Lee, L. Xu, J. Wu, R.-H. Kim, J. Song,

Z. Liu, J. Viventi, B. de Graff, B. Elolampi, M. Mansour, M. J. Slepian, S. Hwang, J.
D. Moss, S.-M. Won, Y. Huang, B. Litt, and J. A. Rogers, "Materials for multifunctional balloon catheters with capabilities in cardiac electrophysiological mapping and ablation therapy.," *Nat. Mater.*, vol. 10, no. 4, pp. 316–23, 2011.

- [101] A. H. Park, S. H. Lee, C. Lee, J. Kim, H. E. Lee, S. B. Paik, K. J. Lee, and D. Kim, "Optogenetic mapping of functional connectivity in freely moving mice via insertable wrapping electrode array beneath the skull," ACS Nano, vol. 10, no. 2, pp. 2791–2802, 2016.
- [102] S. Kumagai, N. Fukuda, H. Tajima, and M. Sasaki, "Photoresist spray coating using a shield plate with an aperture for uniform deposition onto trench-type three-dimensional microdevice structures," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 51, no. 2 PART 2, pp. 2–7, 2012.
- [103] T. Yamaguchi, M. Shibata, S. Kumagai, and M. Sasaki, "Thermocouples fabricated on trench sidewall in microfluidic channel bonded with film cover," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 54, no. 3, p. 30219, 2015.
- [104] X. Fan, "Wafer Level Packaging (WLP): Fan-in, fan-out and three-dimensional integration," 2010 11th Int. Conf. Therm. Mech. Multi-Physics Simulation, Exp. Microelectron. Microsystems, EuroSimE 2010, 2010.
- [105] T. A. Harder, T.-J. Yao, Q. He, C.-Y. Shih, and Y.-C. Tai, "Residual stress in thin-film parylene-c," *Tech. Dig. MEMS 2002 IEEE Int. Conf. Fifteenth IEEE Int. Conf. Micro Electro Mech. Syst. (Cat. No.02CH37266)*, pp. 1–4, 2002.
- [106] C. Y. Hsieh, C. S. Chen, W. A. Tsou, Y. T. Yeh, K. A. Wen, and L. Fan, "A flexible mixed-signal/RF CMOS technology for implantable electronics applications," J. *Micromechanics Microengineering*, vol. 20, no. 4, p. 45017, 2010.
- [107] K. Sasagawa, T. Yamaguchi, M. Haruta, Y. Sunaga, Y. Ohta, H. Takehara, H. Takehara, T. Noda, T. Tokuda, and J. Ohta, "An implantable needle shape image sensor with an on-chip thinned LED," in 2016 International Conference on Solid State Devides and Materials(SSDM2016), 2016.
- [108] A. Devor, A. K. Dunn, M. L. Andermann, I. Ulbert, D. A. Boas, and A. M. Dale, "Coupling of total hemoglobin concentration, oxygenation, and neural activity in rat somatosensory cortex," *Neuron*, vol. 39, no. 2, pp. 353–359, 2003.
- [109] A. Grinvald, E. Lieke, R. D. Frostig, C. D. Gilbert, and T. N. Wiesel, "Functional architecture of cortex revealed by optical imaging of intrinsic signals.," *Nature*, vol. 324, no. 6095, pp. 361–4, 1986.
- [110] S. Lee, Y. Inoue, D. Kim, A. Reuveny, K. Kuribara, T. Yokota, J. Reeder, M. Sekino, T. Sekitani, Y. Abe, and T. Someya, "A strain-absorbing design for tissue-machine interfaces using a tunable adhesive gel," *Nat. Commun.*, vol. 5, pp. 1–8, 2014.
- [111] H. Hayami, H. Takehara, K. Nagata, M. Haruta, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, and J. Ohta, "Wireless image-data transmission from an implanted image sensor through a

living mouse brain by intra body communication," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 55, no. 4, 2016.

- [112] H. Takehara, H. Hayami, K. Nagata, Y. Ohta, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, and J. Ohta, "Implantable micro-sized image sensor for data transmission with intra-vital optical communication," *J. Eng.*, vol. 2017, pp. 2–4, 2016.
- [113] A. N. Yaroslavsky, P. C. Schulze, I. V. Yaroslavsky, R. Schober, F. Ulrich, and H. J. Schwarzmaier, "Optical properties of selected native and coagulated human brain tissues in vitro in the visible and near infrared spectral range," *Phys. Med. Biol.*, vol. 47, no. 12, pp. 2059–2073, 2002.